

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年1月27日(27.01.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/018795 A1

(51) 国際特許分類:
H01S 3/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2020/028095

(22) 国際出願日: 2020年7月20日(20.07.2020)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: ギガフォトン株式会社(**GIGAPHOTON INC.**) [JP/JP]; 〒3238558 栃木県小山市大字横倉新田 4 0 0 番地 Tochigi (JP).

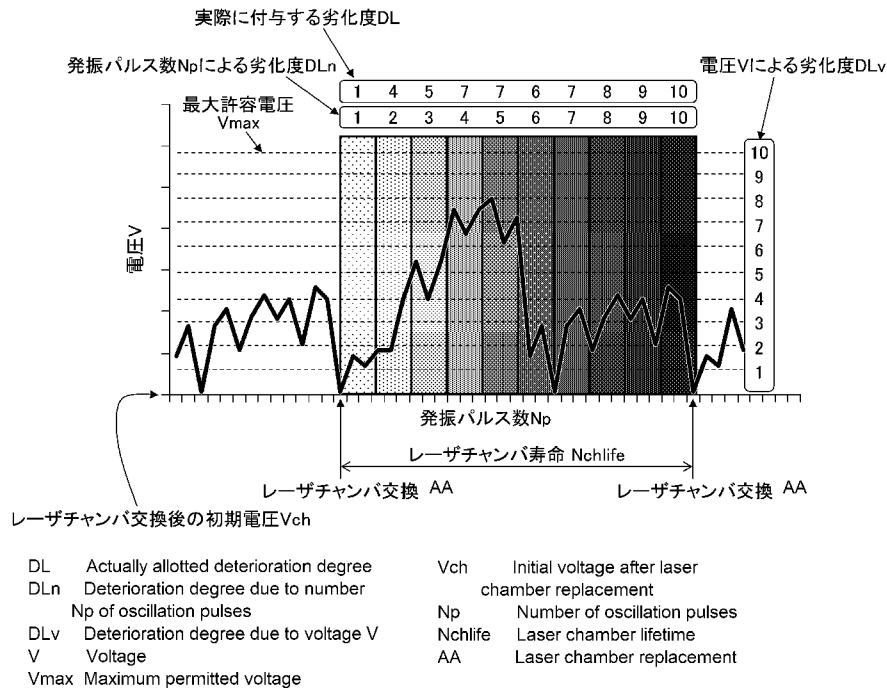
(72) 発明者: 阿部 邦彦(**ABE, Kunihiko**); 〒3238558 栃木県小山市大字横倉新田 4 0 0 番地 ギガフォトン株式会社内 Tochigi (JP).

(74) 代理人: 松浦 憲三 (**MATSUURA, Kenzo**); 〒1630223 東京都新宿区西新宿二丁目 6 番 1 号 新宿住友ビル 2 3 階 新都心国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) **Title:** TRAINING DATA CREATING METHOD, MACHINE LEARNING METHOD, EXPENDABLE ITEM MANAGEMENT DEVICE, AND COMPUTER-READABLE MEDIUM

(54) 発明の名称: 訓練データ作成方法、機械学習方法、消耗品管理装置及びコンピュータ可読媒体



(57) **Abstract:** An aspect of the present disclosure relates to a training data creating method for creating training data for use in machine learning of a learning model for predicting the lifetime of an expendable item of a laser device, the method comprising: acquiring first lifetime-related information including data of at least one lifetime-related parameter of an expendable item, the at least one lifetime-related parameter being recorded corresponding to different numbers of

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

oscillation pulses in a period between the start of use of the expendable item and replacement thereof; defining a first deterioration degree of the expendable item on the basis of a number of oscillation pulses; defining a second deterioration degree of the expendable item on the basis of the at least one lifetime-related parameter; defining a third deterioration degree of the expendable item on the basis of the first deterioration degree and the second deterioration degree; and creating training data in which the first lifetime-related information and the third deterioration degree are associated with each other.

(57) 要約: 本開示の一観点に係る訓練データ作成方法は、レーザ装置の消耗品の寿命を予測するための学習モデルの機械学習に使用する訓練データの作成方法であって、消耗品の使用が開始されてから交換されるまでの期間中の異なる発振パルス数に対応して記録された消耗品の少なくとも1つの寿命関連パラメータのデータを含む第1の寿命関連情報を取得することと、発振パルス数に基づき消耗品の第1の劣化度を定めることと、少なくとも1つの寿命関連パラメータに基づき消耗品の第2の劣化度を定めることと、第1の劣化度と第2の劣化度とに基づき消耗品の第3の劣化度を定めることと、第1の寿命関連情報と第3の劣化度とを対応付けた訓練データを作成することを含む。

明 細 書

発明の名称：

訓練データ作成方法、機械学習方法、消耗品管理装置及びコンピュータ可読媒体

技術分野

[0001] 本開示は、訓練データ作成方法、機械学習方法、消耗品管理装置及びコンピュータ可読媒体に関する。

背景技術

[0002] 半導体集積回路の微細化、高集積化につれて、半導体露光装置においては解像力の向上が要請されている。半導体露光装置を以下、単に「露光装置」という。このため露光用光源から出力される光の短波長化が進められている。露光用光源には、従来の水銀ランプに代わってガスレーザ装置が用いられている。現在、露光用のガスレーザ装置としては、波長248nmの紫外線を出力するKrFエキシマレーザ装置ならびに、波長193nmの紫外線を出力するArFエキシマレーザ装置が用いられている。

[0003] 現在の露光技術としては、露光装置側の投影レンズとウエハ間の間隙を液体で満たして、当該間隙の屈折率を変えることによって、露光用光源の見かけの波長を短波長化する液浸露光が実用化されている。ArFエキシマレーザ装置を露光用光源として用いて液浸露光が行われた場合は、ウエハには等価における波長134nmの紫外光が照射される。この技術をArF液浸露光という。ArF液浸露光はArF液浸リソグラフィとも呼ばれる。

[0004] KrF、ArFエキシマレーザ装置の自然発振におけるスペクトル線幅は約350～400pmと広いため、露光装置側の投影レンズによってウエハ上に縮小投影されるレーザ光（紫外線光）の色収差が発生して解像力が低下する。そこで色収差が無視できる程度となるまでガスレーザ装置から出力されるレーザ光のスペクトル線幅を狭帯域化する必要がある。スペクトル線幅はスペクトル幅とも呼ばれる。このためガスレーザ装置のレーザ共振器内に

は狭帯域化素子を有する狭帯域化部（Line Narrow Module）が設けられ、この狭帯域化部によりスペクトル幅の狭帯域化が実現されている。なお、狭帯域化素子はエタロンやグレーティング等であってもよい。このようにスペクトル幅が狭帯域化されたレーザ装置を狭帯域化レーザ装置という。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献1：米国特許出願公開第2018/0246494号

特許文献2：米国特許第6219367号

特許文献3：米国特許第6697695号

概要

[0006] 本開示の1つの観点に係る訓練データ作成方法は、レーザ装置の消耗品の寿命を予測するための学習モデルの機械学習に使用する訓練データの作成方法であって、消耗品の使用が開始されてから交換されるまでの期間中の異なる発振パルス数に対応して記録された消耗品の少なくとも1つの寿命関連パラメータのデータを含む第1の寿命関連情報を取得することと、発振パルス数に基づき消耗品の第1の劣化度を定めることと、少なくとも1つの寿命関連パラメータに基づき消耗品の第2の劣化度を定めることと、第1の劣化度と第2の劣化度とに基づき消耗品の第3の劣化度を定めることと、第1の寿命関連情報と第3の劣化度とを対応付けた訓練データを作成することを含む。

[0007] 本開示の他の1つの観点に係る機械学習方法は、レーザ装置の消耗品の寿命を予測するための学習モデルを作成する機械学習方法であって、消耗品の使用が開始されてから交換されるまでの期間中の異なる発振パルス数に対応して記録された消耗品の少なくとも1つの寿命関連パラメータのデータを含む第1の寿命関連情報を取得することと、発振パルス数に基づき消耗品の第1の劣化度を定めることと、少なくとも1つの寿命関連パラメータに基づき消耗品の第2の劣化度を定めることと、第1の劣化度と第2の劣化度とに基づき消耗品の第3の劣化度を定めることと、第1の寿命関連情報と第3の劣

化度とを対応付けた訓練データを作成することと、訓練データを用いて機械学習を行うことにより、第1の寿命関連情報に含まれる寿命関連パラメータのデータから消耗品の劣化度を予測する学習モデルを作成することと、作成された学習モデルを保存することを含む。

[0008] 本開示の他の1つの観点に係るコンピュータ可読媒体は、プログラムが記録された非一過性のコンピュータ可読媒体であって、プログラムは、コンピュータにより実行された場合に、レーザ装置の消耗品の寿命を予測するための学習モデルの機械学習に使用する訓練データの作成機能を実現させるプログラムであり、消耗品の使用が開始されてから交換されるまでの期間中の異なる発振パルス数に対応して記録された消耗品の少なくとも1つの寿命関連パラメータのデータを含む第1の寿命関連情報を取得する機能と、発振パルス数に基づき消耗品の第1の劣化度を定める機能と、少なくとも1つの寿命関連パラメータに基づき消耗品の第2の劣化度を定める機能と、第1の劣化度と第2の劣化度とに基づき消耗品の第3の劣化度を定める機能と、第1の寿命関連情報と第3の劣化度とを対応付けた訓練データを作成する機能と、をコンピュータに実現させるための命令を含む。

図面の簡単な説明

[0009] 本開示のいくつかの実施形態を、単なる例として、添付の図面を参照して以下に説明する。

[図1]図1は、例示的なレーザ装置の構成を概略的に示す図である。

[図2]図2は、半導体工場のレーザ管理システムの構成例を概略的に示す図である。

[図3]図3は、典型的なレーザチャンバのガス圧と発振パルス数との関係の例を示すグラフである。

[図4]図4は、実施形態1に係る半導体工場のレーザ管理システムの構成を示す図である。

[図5]図5は、消耗品管理サーバの機能を示すブロック図である。

[図6]図6は、データ取得部における処理内容の例を示すフローチャートであ

る。

[図7]図7は、学習モデル作成部における処理内容の例を示すフローチャートである。

[図8]図8は、レーザチャンバの電圧と発振パルス数との関係の例を示すグラフであり、発振パルス数と電圧とに基づきレーザチャンバの寿命までの劣化度を付与する例を示す。

[図9]図9は、レーザチャンバの電圧と発振パルス数との関係の例を示すグラフであり、発振パルス数と電圧とに基づきレーザチャンバの寿命までの劣化度を付与する他の例を示す。

[図10]図10は、レーザチャンバのガス圧と発振パルス数との関係の例を示すグラフであり、発振パルス数とガス圧と電圧とに基づきレーザチャンバの寿命までの劣化度を付与する例を示す。

[図11]図11は、図7のステップS48に適用される処理内容の例1を示すフローチャートである。

[図12]図12は、図11のステップS104に適用される処理内容の例1を示すフローチャートである。

[図13]図13は、図11のステップS104に適用される処理内容の例2を示すフローチャートである。

[図14]図14は、図11のステップS104に適用される処理内容の例3を示すフローチャートである。

[図15]図15は、電圧とガス圧の2つの値から導き出される特徴量に基づいて劣化度を付与する例を示す図である。

[図16]図16は、電圧とガス圧の2つの値から導き出される特徴量に基づいて劣化度を付与する他の例を示す図である。

[図17]図17は、発振パルス数でレベル分けされた1つの劣化度の区間に複数のデータが含まれるイメージを示すグラフである。

[図18]図18は、図7のステップS48に適用される処理内容の例2を示すフローチャートである。

[図19]図19は、図18のステップS104に適用される処理内容の例を示すフローチャートである。

[図20]図20は、ニューラルネットワークモデルの例を示す模式図である。

[図21]図21は、学習モデルを作成する際のニューラルネットワークのモデルの例である。

[図22]図22は、消耗品の寿命予測部における処理内容の例を示すフローチャートである。

[図23]図23は、図22のステップS70に適用される処理内容の例を示すフローチャートである。

[図24]図24は、作成した学習モデルを使用してレーザチャンバの寿命及び余寿命を計算する例を示すグラフである。

[図25]図25は、10段階にレベル分けされた劣化度毎の確率の例を示す図表である。

[図26]図26は、学習済みのニューラルネットワークモデルによって消耗品の寿命を予測する処理の例を示す図である。

[図27]図27は、データ出力部における処理内容の例を示すフローチャートである。

[図28]図28は、レーザチャンバの寿命関連情報の例を示す図表である。

[図29]図29は、レーザチャンバの寿命関連情報の例を示す図表である。

[図30]図30は、レーザチャンバの寿命関連情報の例を示す図表である。

[図31]図31は、モニタモジュールの寿命関連情報の例を示す図表である。

[図32]図32は、狭帯域化モジュールの寿命関連情報の例を示す図表である。

実施形態

[0010] 一 目次

1. 用語の説明

2. レーザ装置の説明

2. 1 構成

- 2. 2 動作
- 2. 3 レーザ装置の主要な消耗品のメンテナンス
- 2. 4 その他
- 3. 半導体工場のレーザ管理システムの例
 - 3. 1 構成
 - 3. 2 動作
- 4. 課題
- 5. 実施形態 1
 - 5. 1 構成
 - 5. 2 動作
 - 5. 2. 1 消耗品管理サーバにおける機械学習の動作の概要
 - 5. 2. 2 消耗品管理サーバにおける消耗品の寿命予測の動作の概要
 - 5. 2. 3 データ取得部の処理例
 - 5. 2. 4 学習モデル作成部の処理例
 - 5. 2. 5 レーザチャンバの寿命予測に用いる学習モデルの作成例 1
 - 5. 2. 6 レーザチャンバの寿命予測に用いる学習モデルの作成例 2
 - 5. 2. 7 複数のパラメータを組み合わせで 1 つのパラメータに変換する例
 - 5. 2. 8 データ D (s) が複数のデータ件数を含む場合の説明
 - 5. 2. 9 ニューラルネットワークモデルの例
 - 5. 2. 10 ニューラルネットワークモデルの学習モード
 - 5. 2. 11 消耗品の寿命予測部の処理例
 - 5. 2. 12 学習モデルを使って消耗品の寿命を計算する処理の例
 - 5. 2. 13 ニューラルネットワークモデルの寿命予測モード
 - 5. 2. 14 その他
 - 5. 2. 15 データ出力部の処理例
 - 5. 3 レーザチャンバの寿命関連情報
 - 5. 4 モニタモジュールの寿命関連情報の例

5. 5 狭帯域化モジュールの寿命関連情報の例

5. 6 作用・効果

5. 7 その他

6. 変形例

7. プログラムを記録したコンピュータ可読媒体について

以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら詳しく説明する。以下に説明される実施形態は、本開示のいくつかの例を示すものであって、本開示の内容を限定するものではない。また、各実施形態で説明される構成及び動作の全てが本開示の構成及び動作として必須であるとは限らない。なお、同一の構成要素には同一の参照符号を付して、重複する説明を省略する。

[0011] 1. 用語の説明

「消耗品」は、定期的なメンテナンスが必要になる部品やモジュールなどの物品を包括的に表す用語として用いる。交換部品及び交換モジュールは「消耗品」の概念に含まれる。モジュールは、部品の一形態と理解してもよい。本明細書では「消耗品」という用語を「交換モジュール又は交換部品」と同義に用いる場合がある。メンテナンスには、消耗品の交換が含まれる。「交換」の概念には、消耗品を新しいものに置き換えることその他、消耗品を洗浄するなどして部品の機能の維持及び／又は回復を図り、同じ消耗品を再配置することも含まれる。

[0012] 「バースト運転」とは、露光に合わせて狭帯域化したパルスレーザ光を連続して発振するバースト期間と、ステージの移動に合わせて発振休止する発振休止期間とを交互に繰り返す運転のことを意味する。

[0013] 2. レーザ装置の説明

2. 1 構成

図1に、例示的なレーザ装置10の構成を概略的に示す。レーザ装置10は、例えば、KrFエキシマレーザ装置であって、レーザ制御部90と、レーザチャンバ100と、インバータ102と、出力結合ミラー104と、狭

帯域化モジュール (Line Narrow Module: LNM) 106と、モニタモジュール108と、充電器110と、パルスパワーモジュール (PPM) 112と、ガス供給装置114と、ガス排気装置116と、出射口シャッタ118とを含む。

[0014] レーザチャンバ100は、第1ウインドウ121と、第2ウインドウ122と、クロスフローファン (CFF) 123と、CFF 123を回転させるモータ124と、1対の電極125、126と、電気絶縁物127と、圧力センサ128と、図示しない熱交換器とを含む。

[0015] インバータ102は、モータ124の電源供給装置である。インバータ102は、モータ124に供給する電力の周波数を特定する指令信号をレーザ制御部90から受信する。

[0016] PPM 112は、レーザチャンバ100の電気絶縁物127中のフィードスルーを介して電極125と接続される。PPM 112は、半導体スイッチ129と、いずれも図示しない、充電コンデンサと、パルストランスと、パルス圧縮回路とを含む。

[0017] 出力結合ミラー104は部分反射ミラーであって、狭帯域化モジュール106とともに光共振器を構成するように配置される。レーザチャンバ100は、この光共振器の光路上に配置される。

[0018] 狭帯域化モジュール106は、第1プリズム131及び第2プリズム132を用いたビームエキスパンダと、回転ステージ134と、グレーティング136とを含む。第1プリズム131及び第2プリズム132は、レーザチャンバ100の第2ウインドウ122から出射された光のビームを拡大し、グレーティング136に入射するように配置される。

[0019] ここで、グレーティング136はレーザ光の入射角と回折角とが一致するようにリトロ配置される。第2プリズム132は、回転ステージ134が回転したときに、レーザ光のグレーティング136への入射角と回折角とが変化するように回転ステージ134上に配置される。

[0020] モニタモジュール108は、第1ビームスプリッタ141及び第2ビーム

スプリッタ 142 と、パルスエネルギー検出器 144 と、スペクトル検出器 146 とを含む。第 1 ビームスプリッタ 141 は、出力結合ミラー 104 から出力されたレーザ光の光路上に配置され、レーザ光の一部が反射されて第 2 ビームスプリッタ 142 に入射するように配置される。

[0021] パルスエネルギー検出器 144 は、第 2 ビームスプリッタ 142 を透過したレーザ光が入射するように配置される。パルスエネルギー検出器 144 は、例えば、紫外線の光強度を計測するフォトダイオードであってもよい。第 2 ビームスプリッタ 142 は、レーザ光の一部が反射されてスペクトル検出器 146 に入射するように配置される。

[0022] スペクトル検出器 146 は、例えば、エタロンによって生成された干渉縞をイメージセンサで計測するモニタエタロン計測装置である。生成された干渉縞に基づいて、レーザ光の中心波長とスペクトル線幅とが計測される。

[0023] KrF エキシマレーザ装置の場合におけるガス供給装置 114 は、不活性なレーザガスの供給源である不活性ガス供給源 152 と、ハロゲンを含むレーザガスの供給源であるハロゲンガス供給源 153 の各々と配管を介して接続される。不活性なレーザガスとは、Kr ガスと Ne ガスの混合ガスである。ハロゲンを含むレーザガスとは、F₂ ガスと Kr ガスと Ne ガスの混合ガスである。ガス供給装置 114 は、レーザチャンバ 100 と配管を介して接続される。

[0024] ガス供給装置 114 は、不活性なレーザガス又はハロゲンを含むレーザガスをそれぞれレーザチャンバ 100 に所定量供給するための、図示しない自動バルブ及びマスフローコントローラをそれぞれ含む。

[0025] ガス排気装置 116 は、レーザチャンバ 100 と配管を介して接続される。ガス排気装置 116 は、ハロゲンを除去する図示しないハロゲンフィルタ及び排気ポンプを含み、ハロゲンを除去したレーザガスが外部に排気されるように構成される。

[0026] 出射口シャッタ 118 は、レーザ装置 10 から外部に出力されるレーザ光の光路上に配置される。

[0027] 出射口シャッタ 118 を介してレーザ装置 10 から出力されたレーザ光が露光装置 14 に入射するようにレーザ装置 10 が配置される。

[0028] 2. 2 動作

レーザ装置 10 の動作について説明する。レーザ制御部 90 は、ガス排気装置 116 を介してレーザチャンバ 100 内にあるガスを排気した後、ガス供給装置 114 を介してレーザチャンバ 100 内に不活性なレーザガスとハロゲンを含むレーザガスとを所望のガス組成及び全ガス圧となるように充填する。

[0029] レーザ制御部 90 は、インバータ 102 を介してモータ 124 を所定の回転数で回転させて C F F 123 を回転させる。これにより、電極 125、126 間にレーザガスが流れる。

[0030] レーザ制御部 90 は、露光装置 14 の露光制御部 50 から目標パルスエネルギー E_t を受信し、パルスエネルギーが E_t となるように充電電圧 V_{hv} のデータを充電器 110 に送信する。

[0031] 充電器 110 は、P P M 112 の充電コンデンサが充電電圧 V_{hv} となるように充電する。露光装置 14 から発光トリガ信号 T_r1 が出力されると、発光トリガ信号 T_r1 に同期してレーザ制御部 90 からトリガ信号 T_r2 が P P M 112 の半導体スイッチ 129 に入力される。この半導体スイッチ 129 が動作すると P P M 112 の磁気圧縮回路によって電流パルスが圧縮され、高電圧が電極 125、126 間に印加される。その結果、電極 125、126 間で放電が発生し、放電空間においてレーザガスが励起される。電極 125、126 は本開示における「放電電極」の一例である。

[0032] 放電空間の励起されたレーザガスが基底状態となるときに、エキシマ光が発生する。このエキシマ光は出力結合ミラー 104 と狭帯域化モジュール 106 との間を往復して増幅されることによって、レーザ発振する。その結果、出力結合ミラー 104 から狭帯域化されたパルスレーザ光が出力される。

[0033] 出力結合ミラー 104 から出力されたパルスレーザ光はモニタモジュール 108 に入射する。モニタモジュール 108 では、第 1 ビームスプリッタ 1

4 1 によってレーザ光の一部がサンプルされ、第2ビームスプリッタ 1 4 2 に入射する。第2ビームスプリッタ 1 4 2 は、入射したレーザ光の一部を透過してパルスエネルギー検出器 1 4 4 に入射させ、他の一部を反射してスペクトル検出器 1 4 6 に入射させる。

[0034] レーザ装置 1 0 から出力されるパルスレーザ光のパルスエネルギー E がパルスエネルギー検出器 1 4 4 によって計測され、計測されたパルスエネルギー E のデータがパルスエネルギー検出器 1 4 4 からレーザ制御部 9 0 に送信される。

[0035] また、スペクトル検出器 1 4 6 によって中心波長 λ とスペクトル線幅 $\Delta \lambda$ とが計測され、計測された中心波長 λ とスペクトル線幅 $\Delta \lambda$ とのデータがスペクトル検出器 1 4 6 からレーザ制御部 9 0 に送信される。

[0036] レーザ制御部 9 0 は、露光装置 1 4 から目標パルスエネルギー E_t と目標波長 λ_t とのデータを受信する。レーザ制御部 9 0 は、パルスエネルギー検出器 1 4 4 によって計測されたパルスエネルギー E と目標パルスエネルギー E_t とを基に、パルスエネルギーの制御を行う。パルスエネルギーの制御は、パルスエネルギー検出器 1 4 4 によって計測されたパルスエネルギー E と目標パルスエネルギー E_t との差 $\Delta E = E - E_t$ が 0 に近づくように充電電圧 V_{hv} を制御することを含む。

[0037] レーザ制御部 9 0 は、スペクトル検出器 1 4 6 によって計測された中心波長 λ と目標波長 λ_t とを基に、波長の制御を行う。波長の制御は、スペクトル検出器 1 4 6 によって計測された中心波長 λ と目標波長 λ_t との差 $\delta \lambda = \lambda - \lambda_t$ が 0 に近づくように回転ステージ 1 3 4 の回転角を制御することを含む。

[0038] 以上のようにレーザ制御部 9 0 は、露光装置 1 4 から目標パルスエネルギー E_t と目標波長 λ_t とを受信して、発光トリガ信号 Tr_1 が入力される毎に、発光トリガ信号 Tr_1 に同期してレーザ装置 1 0 にパルスレーザ光を出力させる。

[0039] レーザ装置 1 0 は放電を繰り返すと、電極 1 2 5、1 2 6 が消耗し、レーザガス中のハロゲンガスが消費されるとともに、不純物ガスが生成される。

レーザチャンバ１００内のハロゲンガス濃度の低下や不純物ガスの増加は、パルスレーザ光のパルスエネルギーの低下やパルスエネルギーの安定性に悪影響を及ぼす。レーザ制御部９０は、これらの悪影響を抑制するために例えば、以下のガス制御を実行する。

[0040] [１] ハロゲン注入制御

ハロゲン注入制御とは、レーザ発振中に、レーザチャンバ１００内で主に放電によって消費された分のハロゲンガスを、レーザチャンバ１００内のハロゲンガスよりも高い濃度にハロゲンを含むガスを注入することによってレーザチャンバ１００に補充するガス制御である。

[0041] [２] 部分ガス交換制御

部分ガス交換制御とは、レーザ発振中に、レーザチャンバ１００内の不純物ガスの濃度の増加を抑制するように、レーザチャンバ１００内のレーザガスの一部を新しいレーザガスに交換するガス制御である。

[0042] [３] ガス圧制御

ガス圧制御とは、レーザチャンバ１００内にレーザガスを注入してレーザガスのガス圧 P を変化させることによって、パルスエネルギーを制御するガス制御である。パルスエネルギーの制御は、通常、充電電圧 V_{hv} を制御することで行われるが、レーザ装置１０から出力されるパルスレーザ光のパルスエネルギーの低下を、充電電圧 V_{hv} の制御範囲では補うことが不可能な場合に、ガス圧制御が実行される。

[0043] レーザチャンバ１００からレーザガスを排気する場合に、レーザ制御部９０はガス排気装置１１６を制御する。レーザチャンバ１００から排気されたレーザガスは図示しないハロゲンフィルタによってハロゲンガスが除去され、レーザ装置１０の外部に排気される。

[0044] レーザ制御部９０は、発振パルス数、充電電圧 V_{hv} 、レーザチャンバ１００内のガス圧 P 、レーザ光のパルスエネルギー E 、スペクトル線幅 $\Delta\lambda$ 等の各パラメータのデータを、図示しないローカルエリアネットワークを介してレーザ装置用管理システム２０６（図２参照）に送信する。

[0045] 2. 3 レーザ装置の主要な消耗品のメンテナンス

フィールドサービスエンジニア（FSE）が行う主要な消耗品の交換作業は、レーザチャンバ100と、狭帯域化モジュール106と、モニタモジュール108との交換作業である。

[0046] これらの主要な消耗品の交換時期は、一般的には、時間で管理するのではなく、レーザ装置10の発振パルス数で管理している。これらの主要な消耗品の交換作業には、3時間から10時間の交換時間を要することがある。これらの主要な消耗品の中で、交換時間が最も長い消耗品はレーザチャンバ100である。

[0047] 2. 4 その他

図1に示す例では、レーザ装置10として、KrFエキシマレーザ装置の例を示したが、この例に限定されることなく、他のレーザ装置に適用してもよい。例えば、レーザ装置10は、ArFエキシマレーザ装置やXeClエキシマレーザ装置であってもよい。

[0048] 図1に示す例では、レーザ装置10のガス制御は、ハロゲン注入制御と、部分ガス交換制御と、ガス圧制御とを実施する場合を示したが、この例に限定されることなく、例えば、必ずしもガス圧制御を実施しなくてもよい。

[0049] 3. 半導体工場のレーザ管理システムの例

3. 1 構成

図2に、半導体工場のレーザ管理システム200の構成例を概略的に示す。レーザ管理システム200は、複数のレーザ装置10と、レーザ装置用管理システム206と、半導体工場管理システム208とを含む。

[0050] レーザ装置用管理システム206及び半導体工場管理システム208の各々は、コンピュータを用いて構成される。レーザ装置用管理システム206及び半導体工場管理システム208の各々は、複数のコンピュータを用いて構成されるコンピュータシステムであってもよい。半導体工場管理システム208は、ネットワーク210を介して、レーザ装置用管理システム206と接続される。

[0051] ネットワーク 210 は、有線若しくは無線又はこれらの組み合わせによる情報伝達が可能な通信回線である。ネットワーク 210 は、ワイドエリアネットワークであってもよいし、ローカルエリアネットワークであってもよい。

[0052] 複数のレーザ装置 10 の各々を識別するために、ここではレーザ装置識別符号 # 1, # 2, ... # k, ... # w を用いる。w は半導体工場内のレーザ管理システム 200 に含まれるレーザ装置 10 の数である。w は 1 以上の整数である。k は 1 以上 w 以下の範囲の整数である。以下、説明の便宜上、レーザ装置 # k と表記する場合がある。なお、レーザ装置 # 1 ~ # w は同一の装置構成であってもよいし、レーザ装置 # 1 ~ # w の一部又は全部は、互いに異なる装置構成であってもよい。

[0053] レーザ装置 # 1 ~ # w とレーザ装置用管理システム 206 との各々は、ローカルエリアネットワーク 213 に接続される。図 2 において、ローカルエリアネットワーク 213 を「LAN」と表示する。

[0054] 3. 2 動作

レーザ装置用管理システム 206 は、それぞれのレーザ装置 # 1 ~ # w の主要な消耗品の交換時期を、主にレーザ発振したパルス数（発振パルス数） N_p で管理する。

[0055] レーザ装置用管理システム 206 は、メンテナンスの管理情報を表示端末に表示してもよいし、ネットワーク 210 を介して半導体工場管理システム 208 に送信してもよい。

[0056] レーザ装置用管理システム 206 によってレーザ装置 # 1 ~ # w を管理する管理ラインは、それぞれの管理ラインが独立しており、各レーザ装置 # 1 ~ # w から出力されたメンテナンス管理の情報に基づいて、半導体工場の管理者が各レーザ装置 # 1 ~ # w の主要な消耗品の交換時期を決定する。

[0057] 図 3 は、典型的なレーザチャンバ 100 のガス圧 P と発振パルス数 N_p との関係の例を示すグラフである。エキシマレーザ装置は放電を繰り返すと、電極 125、126 が消耗し、レーザガス中のハロゲンガスが消費されると

ともに、不純物ガスが生成される。レーザチャンバ100内のハロゲンガス濃度の低下や不純物ガスの増加は、パルスレーザ光のパルスエネルギーの低下やパルスエネルギー安定性に悪影響を及ぼす。

[0058] そこで、エキシマレーザ装置の性能を維持するために、状況に応じて、ハロゲン注入制御、部分ガス交換制御、ガス圧制御、又は全ガス交換を行う。図3においてレーザチャンバ100の交換タイミングを上向き矢印で示す。レーザチャンバ100を交換した後の動作は次の通りである。

[0059] [ステップ1] レーザチャンバ100を交換した直後のガス圧 P は、初期ガス圧 P_{ch} でレーザ性能が維持される。

[0060] [ステップ2] レーザ発振を継続すると、放電電極の消耗や不純物ガスの発生により、レーザ性能を維持するために、ガス圧制御によってガス圧 P が上昇する。図3において太線で示すグラフは、このステップ2におけるガス圧 P の推移を表す。

[0061] [ステップ3] しかし、やがてガス圧制御によってもレーザ性能が維持できなくなると、レーザ発振を停止し、全ガス交換を行う。図3において全ガス交換のタイミングを下向き矢印で示す。

[0062] [ステップ4] 全ガス交換後に調整発振を行う。レーザ性能を回復させるために、ガス圧制御を行う。レーザ性能が回復したときのガス圧 P を「全ガス交換後の初期ガス圧」といい、 P_{ini} とする。

[0063] [ステップ5] その後、ステップ2からステップ4を複数回繰り返す。全ガス交換後の初期ガス圧 P_{ini} は、発振パルス数 N_p の増加に伴い次第に大きくなっていく。図3において細線で示すグラフは初期ガス圧 P_{ini} の推移を表す。

[0064] [ステップ6] やがて、ガス圧 P が最大許容ガス圧 P_{max} に到達したときにレーザチャンバ寿命 N_{chlife} となる。

[0065] 図3に示す例では、簡単のためにレーザチャンバ100の寿命について、レーザ装置10の発振パルス数 N_p に対するガス圧 P の変化から寿命に到達するまでの経緯を説明した。しかし、他のレーザ性能、例えば、パルスエネ

ルギ安定性、及びスペクトル線幅等の性能も満足する必要がある。したがって、単純には、レーザチャンバ１００の寿命を予測できないことがある。

[0066] ４．課題

〔課題１〕レーザ装置の主要な消耗品毎に標準寿命としての発振パルス数の値が定められている場合がある。しかし、消耗品の個体差があるために、寿命に到達する発振パルス数は一定ではなく、ばらつきがある。消耗品の寿命が標準寿命より長い場合であっても、標準寿命の時期に、定期メンテナンスとして消耗品の交換を行う場合がある。また、消耗品の寿命が標準寿命より短い場合には、計画的な消耗品交換ができず、生産ラインを停止させることがある。

[0067] 〔課題２〕現状ではＦＳＥが、例えば図３のような発振パルス数に対するガス圧の推移とその他の寿命に関連するパラメータのログデータを見て、経験的に各消耗品の寿命を予測して対応している。そのため、消耗品の寿命の予測及び消耗品の交換までの対応は、ＦＳＥ個人の能力に依存する場合がある。

[0068] ５．実施形態１

５．１ 構成

図４は、実施形態１に係る半導体工場のレーザ管理システム３００の構成を示す図である。図４に示す構成について図２との相違点を説明する。図４に示す半導体工場のレーザ管理システム３００は、図２のレーザ管理システム２００の構成に、消耗品管理サーバ３１０を追加した構成となっている。消耗品管理サーバ３１０はネットワーク２１０を介して、レーザ装置用管理システム２０６及び半導体工場管理システム２０８と接続される。

[0069] 消耗品管理サーバ３１０は、レーザ装置用管理システム２０６及び半導体工場管理システム２０８の各々に対してデータや信号の送受信が可能な構成である。

[0070] 図５は、消耗品管理サーバ３１０の機能を示すブロック図である。消耗品管理サーバ３１０は、データ取得部３２０と、消耗品の寿命関連情報保存部

３３０と、機械学習による学習モデル作成部３４０と、学習モデル保存部３５０と、消耗品の寿命予測部３６０と、データ出力部３７０とを含む。

[0071] 消耗品の寿命関連情報は、ファイルＡ、ファイルＢ及びファイルＣを含む。ファイルＡは、レーザチャンバ１００の寿命関連ログデータが保存されるファイルである。ファイルＢは、モニタモジュール１０８の寿命関連ログデータが保存されるファイルである。ファイルＣは、狭帯域化モジュール１０６の寿命関連ログデータが保存されるファイルである。

[0072] 消耗品の寿命関連情報保存部３３０は、ファイルＡを記憶しておく記憶部３３２と、ファイルＢを記憶しておく記憶部３３４と、ファイルＣを記憶しておく記憶部３３６とを含む。

[0073] 学習モデル作成部３４０は、機械学習によって学習モデルを作成する処理部である。消耗品の学習モデル保存部３５０は、学習モデル作成部３４０によって作成された学習モデルを保存する。消耗品の学習モデル保存部３５０は、ファイルＡ_mを記憶しておく記憶部３５２と、ファイルＢ_mを記憶しておく記憶部３５４と、ファイルＣ_mを記憶しておく記憶部３５６とを含む。

[0074] ファイルＡ_mは、レーザチャンバ１００の寿命を予測する処理を行う第１学習モデルが保存されるファイルである。ファイルＢ_mは、モニタモジュール１０８の寿命を予測する処理を行う第２学習モデルが保存されるファイルである。ファイルＣ_mは、狭帯域化モジュール１０６の寿命を予測する処理を行う第３学習モデルが保存されるファイルである。

[0075] 記憶部３３２、３３４、３３６、３５２、３５４、３５６は、ハードディスク装置及び／又は半導体メモリ等の記憶デバイスを用いて構成される。記憶部３３２、３３４、３３６、３５２、３５４、３５６は、それぞれ別々の記憶装置を用いて構成されてもよいし、１つ又は複数の記憶装置における記憶領域の一部として構成されてもよい。

[0076] 本開示において、レーザ制御部９０、露光制御部５０、レーザ装置用管理システム２０６、半導体工場管理システム２０８、及び消耗品管理サーバ３１０の各々は、１台又は複数台のコンピュータのハードウェア及びソフトウ

エアの組み合わせによって実現することが可能である。ソフトウェアはプログラムと同義である。プログラマブルコントローラはコンピュータの概念に含まれる。

[0077] コンピュータは、例えば、CPU（Central Processing Unit）及び記憶装置を含んで構成され得る。プログラマブルコントローラはコンピュータの概念に含まれる。コンピュータはGPU（Graphics Processing Unit）を含んでもよい。コンピュータに含まれるCPUやGPUはプロセッサの一例である。記憶装置は、有体物たる非一時的なコンピュータ可読媒体であり、例えば、主記憶装置であるメモリ及び補助記憶装置であるストレージを含む。コンピュータ可読媒体は、例えば、半導体メモリ、ハードディスクドライブ（Hard Disk Drive：HDD）装置、若しくはソリッドステートドライブ（Solid State Drive：SSD）装置又はこれらの複数の組み合わせであってよい。プロセッサが実行するプログラムはコンピュータ可読媒体に記憶されている。プロセッサはコンピュータ可読媒体を含む構成であってもよい。

[0078] また、レーザ制御部90、露光制御部50、レーザ装置用管理システム206、半導体工場管理システム208及び消耗品管理サーバ310などの各種の制御装置や処理装置の機能の一部又は全部は、FPGA（Field Programmable Gate Array）やASIC（Application Specific Integrated Circuit）に代表される集積回路を用いて実現してもよい。

[0079] また、複数の制御装置や処理装置の機能を1台の装置で実現することも可能である。さらに本開示において、複数の制御装置や処理装置は、ローカルエリアネットワークやインターネット回線といった通信ネットワークを介して互いに接続されてもよい。分散コンピューティング環境において、プログラムユニットは、ローカル及びリモート両方のメモリストレージデバイスに保存されてもよい。レーザ制御部90、露光制御部50、レーザ装置用管理システム206、半導体工場管理システム208、及び消耗品管理サーバ310などに適用されるプロセッサは、本開示に含まれる各種処理を実行するために特別に構成又はプログラムされている。

[0080] 5. 2 動作

5. 2. 1 消耗品管理サーバにおける機械学習の動作の概要

図5に示す消耗品管理サーバ310は、レーザ装置10の消耗品の寿命を予測する処理に用いる学習モデルを作成するための機械学習を行う機能と、作成した学習モデルを用いて消耗品の寿命を予測する処理を行う機能とを備える。消耗品管理サーバ310は本開示における「消耗品管理装置」の一例である。まず、消耗品管理サーバ310において消耗品の寿命の予測に用いる学習モデルを作成するための機械学習方法及びその機械学習に使用する訓練データの作成方法を説明する。

[0081] データ取得部320は、各レーザ装置10で消耗品が交換された場合に、レーザ装置用管理システム206から、交換された消耗品の使用期間中の全期間にわたって発振パルス数 N_p と対応付けて継続的に記録された寿命関連パラメータの全データを含む寿命関連情報を取得する。データ取得部320は、レーザ装置用管理システム206から取得したデータを、消耗品の寿命関連情報保存部330に書き込む。

[0082] データ取得部320は、交換された消耗品の種類に応じて書き込むファイルを特定してデータを書き込む。交換された消耗品がレーザチャンバ100である場合、データ取得部320はファイルAにレーザチャンバ100の寿命関連情報である寿命関連ログデータを書き込む。交換された消耗品がモニタモジュール108である場合、データ取得部320はファイルBにモニタモジュール108の寿命関連情報である寿命関連ログデータを書き込む。交換された消耗品が狭帯域化モジュール106である場合、データ取得部320はファイルCに狭帯域化モジュール106の寿命関連情報である寿命関連ログデータを書き込む。ファイルA、ファイルB、及びファイルCの各々に書き込まれるログデータは本開示における「第1の寿命関連情報」の一例である。データ取得部320は本開示における「情報取得部」の一例である。

[0083] 学習モデル作成部340は、消耗品の寿命関連情報保存部330に、交換された消耗品に関する新しい寿命関連情報のデータが保存されると、この新

しく保存された寿命関連情報のデータを取得する。また、学習モデル作成部 340 は、交換された消耗品に対応した学習モデルを消耗品の学習モデル保存部 350 から呼び出す。

[0084] 例えば、交換された消耗品がレーザチャンバ 100 である場合、学習モデル作成部 340 はファイル A m を呼び出す。交換された消耗品がモニタモジュール 108 である場合、学習モデル作成部 340 はファイル B m を呼び出す。交換された消耗品が狭帯域化モジュール 106 である場合、学習モデル作成部 340 はファイル C m を呼び出す。

[0085] 学習モデル作成部 340 は、交換された消耗品の使用開始から交換までの期間中に記録された寿命関連パラメータのデータに基づいて機械学習を行い、新しい学習モデルを作成する。具体的な機械学習方法の内容については後述する。学習モデル作成部 340 によって作成された新しい学習モデルは、消耗品の学習モデル保存部 350 に保存される。機械学習の実施によって新しい学習モデルが作成されると、学習モデル保存部 350 のファイルが更新され、学習モデル保存部 350 に最新の学習モデルのファイルが書き込まれる。

[0086] 5. 2. 2 消耗品管理サーバにおける消耗品の寿命予測の動作の概要
次に、消耗品管理サーバ 310 における消耗品の寿命予測の動作を説明する。データ取得部 320 は、外部装置から交換予定の消耗品の寿命予測処理の要求信号を受信することができる。ここでの外部装置は、半導体工場管理システム 208 であってもよいし、図示しない端末装置などであってもよい。「交換予定の消耗品」とは、レーザ装置 10 に現在搭載されている使用中の消耗品であって、今後交換する予定が検討される候補対象の消耗品である。

[0087] データ取得部 320 は、交換予定の消耗品の寿命予測処理の要求を受けると、レーザ装置用管理システム 206 から、交換予定の消耗品の現在の寿命関連情報のデータと、1 日当りの発振予定パルス数 N_{day} のデータとを取得する。

- [0088] データ取得部320は、交換予定の消耗品の現在の寿命関連情報のデータと、1日当りの発振予定パルス数 N_{day} のデータとを、消耗品の寿命予測部360に送信する。
- [0089] 消耗品の寿命予測部360は、交換予定の消耗品の現在の寿命関連情報のデータと、1日当りの発振予定パルス数 N_{day} のデータとを取得し、交換予定の消耗品に対応した学習モデルを消耗品の学習モデル保存部350から呼び出す。
- [0090] 例えば、交換予定の消耗品がレーザチャンバ100である場合、消耗品の寿命予測部360は消耗品の学習モデル保存部350からファイル A_m を読み込む。
- [0091] 消耗品の寿命予測部360は、現在の寿命関連情報のデータに基づいて学習モデルを使用することによって消耗品の寿命を予測する。
- [0092] 消耗品の寿命予測部360は、予測された交換予定の消耗品の寿命 N_{life} と余命 N_{re} の発振パルス数のデータと、推奨メンテナンス日 D_{rec} とを計算し、これらのデータをデータ出力部370に送信する。
- [0093] 推奨メンテナンス日 D_{rec} は、例えば、次式を用いて計算することができる。
- [0094]
$$D_{rec} = D_{pre} + N_{re} / N_{day}$$

 D_{pre} : 消耗品の現在の寿命関連データの取得日
データ出力部370は、予測された交換予定の消耗品の寿命 N_{life} と余命 N_{re} の発振パルス数のデータと、推奨メンテナンス日 D_{rec} を表すデータとを、ネットワーク210を介してレーザ装置用管理システム206に送信する。データ出力部370は本開示における「情報出力部」の一例である。
- [0095] レーザ装置用管理システム206は、予測された交換予定の消耗品の寿命 N_{life} と余命 N_{re} の発振パルス数と推奨メンテナンス日 D_{rec} の情報を半導体工場管理システム208やオペレータやFSEにディスプレイやメール等で通知してもよい。

[0096] この通知は、消耗品管理サーバ310からネットワーク210を介して、通知されてもよい。

[0097] 5. 2. 3 データ取得部の処理例

図6は、データ取得部320における処理内容の例を示すフローチャートである。図6のフローチャートに示す処理及び動作は、例えば、データ取得部320として機能するプロセッサがプログラムを実行することによって実現される。

[0098] ステップS12において、データ取得部320は消耗品が交換されたか否かを判定する。ステップS12の判定結果がYes判定である場合、データ取得部320はステップS14に進む。ステップS14及びステップS16は学習モデルを作成する場合の処理フローである。

[0099] ステップS14において、データ取得部320は交換された消耗品の使用期間中の全寿命関連情報を受信する。すなわち、レーザ装置10の消耗品の交換が行われると、データ取得部320はレーザ装置用管理システム206から、その交換された消耗品の使用期間中の全寿命関連情報を受信する。

[0100] 次に、ステップS16において、データ取得部320は交換された消耗品の使用期間中の全寿命関連情報を寿命関連情報保存部330に書き込む。すなわち、データ取得部320は、交換された消耗品に対応したファイルにデータを書き込む。ここでは、交換された消耗品はレーザチャンバ100、モニタモジュール108、又は狭帯域化モジュール106であり、データ取得部320は消耗品の種類に応じてファイルA、ファイルB、又はファイルCにデータを書き込む。

[0101] ステップS16の後、データ取得部320はステップS30に進む。ステップS30において、データ取得部320は情報の受信を停止するか否かを判定する。ステップS30の判定結果がNo判定である場合、データ取得部320はステップS12に戻る。

[0102] ステップS12の判定結果がNo判定である場合、データ取得部320はステップS20に進む。ステップS20において、データ取得部320は交

換予定の消耗品の寿命を計算するか否かを判定する。例えば、図示しない入力装置からユーザによって、交換予定の消耗品についての寿命予測の要求が入力された場合に、ステップS 2 0の判定結果がY e s判定となる。

[0103] ステップS 2 0の判定結果がY e s判定である場合、データ取得部3 2 0はステップS 2 2に進む。ステップS 2 2、ステップS 2 4及びステップS 2 6は交換予定の消耗品の予測寿命を計算する場合の処理フローである。消耗品の予測寿命を計算することは、消耗品の寿命を予測することを意味する。

[0104] ステップS 2 2において、データ取得部3 2 0はレーザ装置用管理システム2 0 6から交換予定の消耗品の現在の寿命関連情報を受信する。

[0105] ステップS 2 4において、データ取得部3 2 0はレーザ装置用管理システム2 0 6からレーザ装置1 0の稼動関連情報を受信する。レーザ装置1 0の稼動関連情報とは、1日当りの発振予定パルス数N d a yである。具体的には、過去の稼動データから把握される1日当りの発振予定パルス数N d a yであってよい。若しくは、半導体工場管理システム2 0 8から今後の稼動予定情報を取得して、1日当りの発振予定パルス数N d a yを計算してもよい。

[0106] その後、ステップS 2 6において、データ取得部3 2 0は消耗品の寿命予測部3 6 0に現在の寿命関連情報とレーザ装置1 0の稼動関連情報とを送信する。

[0107] ステップS 2 6の後、データ取得部3 2 0はステップS 3 0に進む。また、ステップS 2 0の判定結果がN o判定である場合、データ取得部3 2 0はステップS 2 2～ステップS 2 6をスキップしてステップS 3 0に進む。

[0108] ステップS 3 0の判定結果がY e s判定である場合、データ取得部3 2 0は図6のフローチャートを終了する。

[0109] 5. 2. 4 学習モデル作成部の処理例

図7は、学習モデル作成部3 4 0における処理内容の例を示すフローチャートである。図7のフローチャートに示す処理及び動作は、例えば、学習モ

デル作成部 340 として機能するプロセッサがプログラムを実行することによって実現される。

- [0110] ステップ S 4 2 において、学習モデル作成部 340 は消耗品の寿命関連情報保存部 330 に新しいデータが書き込まれたか否かを判定する。ステップ S 4 2 の判定結果が N o 判定である場合、学習モデル作成部 340 はステップ S 4 2 を繰り返す。ステップ S 4 2 の判定結果が Y e s 判定である場合、学習モデル作成部 340 はステップ S 4 4 に進む。
- [0111] ステップ S 4 4 において、学習モデル作成部 340 は交換された消耗品の使用期間中の全寿命関連情報を取得する。学習モデル作成部 340 は、交換された消耗品（レーザチャンバ 100、モニタモジュール 108、又は狭帯域化モジュール 106）に対応したファイル（ファイル A、ファイル B、又はファイル C）に書き込まれたデータを取得する。
- [0112] ステップ S 4 6 において、学習モデル作成部 340 は交換された消耗品の学習モデルを呼び出す。すなわち、学習モデル作成部 340 は、交換された消耗品に対応したファイル（ファイル A m、ファイル B m、又はファイル C m）に保存された学習モデルを呼び出す。
- [0113] ステップ S 4 8 において、学習モデル作成部 340 は学習モデルの作成サブルーチンの処理を実行する。学習モデル作成部 340 は、交換された消耗品に対応した学習モデルと寿命関連情報とに基づいて機械学習を行い、新しい学習モデルを作成する。
- [0114] ステップ S 5 0 において、学習モデル作成部 340 は新しく作成された学習モデルを消耗品の学習モデル保存部 350 に保存する。学習モデル作成部 340 は、新しく作成された学習モデルを交換された消耗品に対応したファイル（ファイル A m、ファイル B m、又はファイル C m）に保存する。次回からは、この新しい学習モデルを使用するように、学習モデル保存部 350 には最新の学習モデルが保存される。
- [0115] ステップ S 5 2 において、学習モデル作成部 340 は学習モデルの作成を中止するか否かを判定する。ステップ S 5 2 の判定結果が N o 判定である場

合、学習モデル作成部340はステップS42に戻り、ステップS42からステップS52を繰り返す。ステップS52の判定結果がYes判定である場合、学習モデル作成部340は図7のフローチャートを終了する。

[0116] なお、図7のフローチャートにおいて、各消耗品の学習モデルを最初に作成するときは、学習モデル保存部350に保存されているそれぞれの初期の学習モデルのパラメータは、学習前の任意の値に設定されたものであってよい。後述する機械学習を実施することによって、学習モデルのパラメータが適切な値に変更され、消耗品の寿命予測の処理機能を獲得した学習モデルが作成されることになる。

[0117] もちろん、初期の学習モデルは、予め本実施形態の機械学習方法と同様の方法を実施してパラメータがある程度調整された暫定的な学習モデルであってもよい。

[0118] 5. 2. 5 レーザチャンバの寿命予測に用いる学習モデルの作成例1

学習モデル作成部340が作成する学習モデルは、寿命関連情報の入力を受けて、消耗品の劣化度を予測（推論）結果として出力するように学習される。学習モデル作成部340によって行われる処理には、機械学習に用いる訓練データを作成する処理と、作成した訓練データを用いて機械学習を実施する処理とが含まれる。まず、学習モデル作成部340が実施する訓練データ作成方法の例を説明する。なお、訓練データは「学習用データ」あるいは「学習データ」と同義である。

[0119] 図8は、レーザチャンバ100の電圧Vと発振パルス数N_pとの関係の例を示すグラフであり、発振パルス数N_pと電圧Vとによってレーザチャンバ100の寿命までの劣化度を付与する例を示す。図8の横軸は発振パルス数N_pを表し、縦軸は電極125、126間に印加される電圧Vを表す。ファイルAに保存されているレーザチャンバ100の寿命関連ログデータから、図8のような発振パルス数N_pと関連付けされた電圧Vのデータを読み出すことができる。

[0120] 消耗品交換1サイクルを消耗品毎の寿命とし、発振パルス数N_pによる劣

化度 DL_n を段階的（例えば10段階）に定義する。劣化度 DL_n は、レーザチャンバ100の劣化のレベルを発振パルス数 N_p によって評価したものであり、発振パルス数 N_p が大きくなるにつれて劣化度 DL_n のレベルを示す値が大きい値となる。劣化度 DL_n のレベルが高いほど、つまり劣化度 DL_n のレベルを示す値が大きいほど、劣化が進んだ状態であることを示す。発振パルス数 N_p に応じて10段階の劣化度 DL_n を定義する場合、最小レベル値は1、最大レベル値は10としてよい。

[0121] ここで電極125、126に印加する電圧 V は、ガスの不純物濃度が増加するのに伴うエネルギー低下を補うために、徐々に増加する傾向にある。そこで、最大許容電圧 V_{max} を寿命とし、電圧 V による劣化度 DL_v を段階的（例えば10段階）に定義する。最大許容電圧 V_{max} は、例えば17.5 kV～20.0 kVの範囲の値である。劣化度 DL_v は、レーザチャンバ100の劣化レベルを電圧 V によって評価したものであり、電圧 V が大きくなるにつれて劣化度 DL_v のレベルを示す値が大きい値となる。電圧 V に応じて10段階の劣化度 DL_v を定義する場合、最小レベル値は1、最大レベル値は10としてよい。電圧 V による劣化度 DL_v の上限（最大レベル値）と発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n の上限とは一致させておくことが好ましく、それぞれのパラメータによる劣化度の上限に対する相対的な劣化具合は、概ね揃えておくことが好ましい。電圧 V による劣化度 DL_v のレベル分けについては、予め試験結果又はフィールドデータなどから電圧値とレベル値との対応関係を定めておいてよい。

[0122] 発振パルス数 N_p と電圧 V とのパラメータの組み合わせ（ N_p , V ）によって表されるレーザチャンバ100の状態に対して、実際に寿命までの劣化の度合いを示すラベルとして付与する劣化度 DL は、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n （ N_p ）と、電圧 V による劣化度 DL_v （ V ）とのうち、より劣化のレベルが高い方（レベル値が大きい方）の劣化度とする。図8の例によれば、例えば、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n のレベルが「2」である領域において、電圧 V による劣化度 DL_v のレベルは「4」であるた

め、当該領域に対して実際に付与する劣化度 DL は「4」となる。なお、電圧 V は、取得時のばらつきが大きい場合があるため、ある期間（例えば1週間）の移動平均値を使用してもよい。

[0123] 図8では、電圧 V のデータによる劣化度 DL_v の定義について、レーザチャンバ100交換後の初期電圧 V_{ch} から最大許容電圧 V_{max} までの範囲をレベル1～10の10段階に等分しているが、電圧 V による劣化度 DL_v のレベル分けはこの例に限らない。例えば、図9に示すように、電圧 V に関して閾値電圧 V_{th} を定め、この閾値電圧 V_{th} における劣化度 DL_v をレベル6などのように定め、閾値電圧 V_{th} から最大許容電圧 V_{max} までを等分してレベル6～10を設定してよい。最大許容電圧 V_{max} が例えば19kVである場合、閾値電圧 V_{th} は例えば17.5kVであってもよい。この場合、閾値電圧 V_{th} に満たない低い電圧 V による劣化度 DL_v についてはレベル0としてよい。レベル0とは、劣化度を評価しないこと（無評価）を意味する。閾値電圧 V_{th} は本開示における「所定の閾値」の一例である。

[0124] 図9の例によれば、例えば、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n のレベルが「3」である領域における電圧 V の値は閾値電圧 V_{th} よりも低いため、この領域内での電圧 V による劣化度 DL_v のレベルは「0」である。したがって、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n の評価が優先され、当該領域に対して実際に付与する劣化度 DL は「3」となる。一方、発振パルス数 N_p による劣化度のレベル DL_n が「4」である領域において、電圧 V による劣化度 DL_v のレベルは「7」であるため、当該領域に対して実際に付与する劣化度 DL は、より大きな値の「7」となる。

[0125] このような劣化度の設定によれば、電圧 V が閾値電圧 V_{th} よりも低い場合には、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n が、実際に付与する劣化度 DL として維持される。一方で、電圧 V が閾値電圧 V_{th} 以上に高い場合に、電圧 V による劣化度 DL_v が劣化レベルの後半（レベル6～10）のレベル値として評価される。

- [0126] 電圧 V に関しては、ある一定の電圧値よりも高い電圧となった場合に劣化状態が問題となるという知見から、注意すべき電圧 V の値（閾値電圧 V_{th} ）よりも高い領域について電圧 V による劣化度 DL_v のラベルを与えるという構成を採用してよい。
- [0127] 図9のような劣化度の付与方法を採用することにより、電圧 V が閾値電圧 V_{th} よりも低い領域において、電圧 V による劣化度 DL_v の評価の影響を相対的に低減して、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n の評価の影響を相対的に高めることができる。そして、電圧 V が閾値電圧 V_{th} よりも高い領域において、電圧 V による劣化度 DL_v の評価と発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n の評価とを概ね同程度に重視して両者を比較し、実際に付与する劣化度 DL を決定することができる。この場合に、実際に付与する劣化度 DL は、両パラメータによるそれぞれの劣化度のうち、劣化度のレベルがより高い方の劣化度となる。
- [0128] 図9では、閾値電圧 V_{th} に満たない低い電圧 V による劣化度 DL_v については「レベル0」と定めたが、「レベル0」の代わりに「レベル1」と定めても同様の結果が得られる。つまり、閾値電圧 V_{th} よりも低い電圧 V である場合の電圧 V による劣化度 DL_v は、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n の最小レベル値（レベル1）以下の値としてよい。
- [0129] 図8又は図9で例示したように、発振パルス数 N_p 及び電圧 V の組み合わせ（ N_p , V ）に対して劣化度 DL が付与される。こうして作成された発振パルス数 N_p 及び電圧 V の組み合わせ（ N_p , V ）のパラメータセットと劣化度 DL とを対応付けたデータは、機械学習のための訓練データとして用いられる。すなわち、発振パルス数 N_p と寿命関連パラメータとの組み合わせデータが学習モデルへの入力データとなり、劣化度 DL を表すレベルの値がその入力データに対する劣化度の正解のラベル（教師データ）に相当する。
- [0130] 図8に示す例の場合、発振パルス数 N_p 及び電圧 V の組み合わせ（ N_p , V ）のパラメータセットのデータが学習モデルへの入力データであり、これに対応する劣化度 DL のデータが正解のラベルである。学習モデル作成部3

40は、作成された教師ありデータを用いて機械学習を行い、発振パルス数 N_p 及び電圧 V の組み合わせの入力に対して、劣化度の予測値を出力する学習モデルを作成する。すなわち、学習モデル作成部340は、複数のパラメータの組み合わせによる入力データに対して、10段階の劣化度（レベル1～10）のうちどのレベルに相当するかを予測（推論）する10クラス分類のタスクを行う学習モデルを作成する。なお、ここでは、10段階の劣化度を定義する例を示しているが、劣化度の段階数は10段階に限らず、2以上の適宜の段階とすることができる。

[0131] 発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n は本開示における「第1の劣化度」の一例である。電圧 V による劣化度 DL_v は本開示における「第2の劣化度」の一例である。実際に付与される劣化度 DL は本開示における「第3の劣化度」の一例である。

[0132] 5. 2. 6 レーザチャンバの寿命予測に用いる学習モデルの作成例2

図8及び図9では、発振パルス数 N_p と電圧 V とに基づいて劣化度 DL を付与する例を説明したが、レーザチャンバ100の寿命を評価するために用いるパラメータは、発振パルス数 N_p と電圧 V とに限らない。図3で説明したように、全ガス交換後の初期ガス圧 P_{ini} も電圧 V と同様に、発振パルス数 N_p が増加すると増加する（図3参照）。以下、全ガス交換後の初期ガス圧 P_{ini} を「ガス圧 P_{ini} 」と表記する。そこで、電圧 V による劣化度 DL_v の代わりに、ガス圧 P_{ini} によって劣化度 DL_p を判断してもよい。

[0133] また、電圧 V とガス圧 P_{ini} との両方を使用して劣化度を判断することがより望ましい。その場合、実際に付与する劣化度 DL は、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n 、電圧 V による劣化度 DL_v 、及びガス圧 P_{ini} による劣化度 DL_p のうち、最も大きい値の劣化度を付与してよい。なお、電圧 V と同様に、ガス圧 P_{ini} は、取得時のばらつきが大きい場合があるため、ある期間（例えば1週間）の移動平均値を使用してもよい。

[0134] 図10は、レーザチャンバ100のガス圧 P_{ini} と発振パルス数 N_p と

の関係の例を示すグラフであり、発振パルス数 N_p とガス圧 P_{ini} と電圧 V とに基づきレーザチャンバ100の寿命までの劣化度を定義する例を示す。図10の縦軸はガス圧 P_{ini} を表し、単位は[Pa]である。最大許容ガス圧 P_{max} を寿命とし、ガス圧 P_{ini} による劣化度 DL_p を段階的（例えば10段階）に定義する。

[0135] 図10では、ガス圧 P_{ini} による劣化度 DL_p の定義について、レーザチャンバ100交換後の初期ガス圧 P_{ch} から最大許容ガス圧 P_{max} までの範囲をレベル1～10の10段階に等分しているが、ガス圧 P_{ini} による劣化度 DL_p のレベル分けの設定はこの例に限らない。

[0136] 例えば、ガス圧 P_{ini} に関して閾値となる閾値ガス圧を定め、この閾値ガス圧での劣化度を例えばレベル3とし、最大許容ガス圧 P_{max} のレベル10までを等分してレベル3～10などと設定してよい。例えば、 P_{max} が3300[Pa]である場合、閾値ガス圧は2400[Pa]であってもよい。この場合、レベル3よりも低いガス圧に対応する劣化度についてはレベル0又はレベル1などとしてよい。

[0137] 発振パルス数 N_p とガス圧 P_{ini} とのパラメータの組み合わせ（ N_p ， P_{ini} ）による劣化度 DL_{np} は、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n （ N_p ）と、ガス圧 P_{ini} による劣化度 DL_p （ P_{ini} ）とのうち、より劣化のレベルが高い方の劣化度とする。

[0138] さらに、電圧 V とガス圧 P_{ini} との両方を使用して劣化度を判断する形態の場合、発振パルス数 N_p 、電圧 V 及びガス圧 P の組み合わせ（ N_p ， V ， P_{ini} ）に対して、実際に付与する劣化度 DL_{nvp} は、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n （ N_p ）、電圧 V による劣化度 DL_v （ V ）及びガス圧 P_{ini} による劣化度 DL_p （ P_{ini} ）のうちの最も劣化のレベルが高い劣化度とする。

[0139] 図10の例によれば、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n のレベルが「5」である領域において、ガス圧 P_{ini} による劣化度 DL_p のレベルは「6」であるため、当該領域に対して、発振パルス数 N_p とガス圧 P_{ini} と

の総合判断による劣化度 DL_{np} は「6」となる。また、図10の発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n のレベルが「5」である領域において、電圧 V による劣化度 DL_v のレベルは「7」であるため（図8参照）、当該領域に対して、発振パルス数 N_p と電圧 V とガス圧 P_{ini} との総合判断による劣化度 DL_{nvp} は「7」となる。

[0140] 図10で例示したように、発振パルス数 N_p 、電圧 V 及びガス圧 P_{ini} の組み合わせ（ N_p , V , P_{ini} ）によって表される消耗品の状態に対して、各パラメータによる劣化度 DL_n 、 DL_v 、 DL_p に基づき、劣化度 DL_{nvp} が付与される。こうして作成された発振パルス数 N_p 、電圧 V 及びガス圧 P の組み合わせ（ N_p , V , P_{ini} ）と劣化度 DL_{nvp} とを対応付けたデータは、機械学習のための訓練データとして用いられる。

[0141] このような訓練データを用いて機械学習を行い、発振パルス数 N_p 、電圧 V 及びガス圧 P の組み合わせ（ N_p , V , P_{ini} ）の入力に対して、消耗品の劣化度を示すレベル（すなわち、劣化度のクラス分類ラベル）を予測結果として出力する学習モデルを作成する。電圧 V 及びガス圧 P_{ini} は本開示における「複数の寿命関連パラメータ」の一例である。電圧 V による劣化度 DL_v とガス圧 P_{ini} による劣化度 DL_p とのそれぞれは本開示における「第2の劣化度」の一例である。発振パルス数 N_p と電圧 V とガス圧 P_{ini} とによる総合的な劣化度 DL_{nvp} は本開示における「第3の劣化度」の一例である。

[0142] レーザチャンバ100に限らず、モニタモジュール108や狭帯域化モジュール106など他の消耗品についても同様に、消耗品毎にその消耗品の使用開始から交換までの1サイクルの全期間における寿命関連情報のデータを複数段階の劣化度のレベルに分割し、寿命関連パラメータのデータと劣化度を示すレベルとを対応付けた訓練データを作成する。

[0143] そして、消耗品の種類毎に、それぞれの訓練データを用いて機械学習を行い、それぞれの学習モデルを作成する。

[0144] 図11は、図7のステップS48に適用される処理内容の例1を示すフロ

ーチャートである。すなわち、図 11 は、学習モデルの作成サブルーチンの例 1 を示す。

[0145] 図 11 のステップ S 102 において、学習モデル作成部 340 は交換された消耗品の使用期間中の全寿命関連情報を劣化度のレベルによって S_{max} 段階に分割する。 S_{max} は、例えば、図 8 で例示したように、10 であってよい。

[0146] ステップ S 104 において、学習モデル作成部 340 は S_{max} 段階に分割された各段階の寿命関連情報のデータ $D(s)$ を作成する。ここで s は、劣化度のレベルを表す整数である。 s は 1 から S_{max} までの値をとり得る。図 8 の例では、レーザチャンバ 100 に関して 10 段階にレベル分けされた劣化度 DL の各段階の寿命関連情報のデータ $D(s)$ が作成される。データ $D(s)$ は、寿命関連情報と劣化度 DL のレベル s とが関連付けされたデータであり、訓練データとして用いられる。ステップ S 102 及びステップ S 104 を実施して訓練データを作成する方法は本開示における「訓練データ作成方法」の一例である。

[0147] 次に、ステップ S 106 において、学習モデル作成部 340 は、劣化度のレベルを表す変数 s の値を初期値の「1」に設定する。その後、ステップ S 108 において、学習モデル作成部 340 は $D(s)$ のデータを、図 7 のステップ S 46 で呼び出した学習モデルに入力する。

[0148] 次に、図 11 のステップ S 110 において、学習モデル作成部 340 は、データ $D(s)$ の入力に対する学習モデルの出力がレベル s となるように学習モデルのパラメータを変更する。

[0149] 学習モデルは、例えば、ニューラルネットワークモデルであってよい。学習モデル作成部 340 は、教師ありデータを用いた機械学習によってこの学習モデルのパラメータを変更し、新しい学習モデルを作成する。

[0150] ステップ S 112 において、学習モデル作成部 340 は変数 s が S_{max} 以上であるか否かを判定する。ステップ S 112 の判定結果が No 判定である場合、学習モデル作成部 340 はステップ S 114 に進み、変数 s の値を

インクリメントしてステップS 1 0 8に戻る。ステップS 1 1 2の判定結果がY e s判定である場合、学習モデル作成部3 4 0は図1 1のフローチャートを終了して、図7のフローチャートに復帰する。つまり、ステップS 1 1 2の判定結果がY e s判定になると、学習モデルは、今回の交換された消耗品の結果を反映した新しい学習モデルに更新される。

[0151] なお、図1 1のステップS 1 0 6～S 1 1 2の処理では、劣化度のレベルごとに学習を行う例を説明したが、学習モデルへの訓練データの入力に関して、学習単位はレベルごとではなく、ランダムなサンプルを任意の件数ごと（例えば1 0 0 0件ずつ）に学習する方が好ましい。レベルごとに学習させてしまうと、学習モデルの内部のパラメータが、最後に学習したレベルのデータに寄ってしまう可能性があるため、学習単位となる学習データ群はなるべくランダムサンプリングした方がよい。

[0152] 学習モデル作成部3 4 0は本開示における「訓練データ作成方法」及び「機械学習方法」を実施する処理部の一例である。

[0153] 図1 2は、図1 1のステップS 1 0 4に適用される処理内容の例1を示すフローチャートである。図1 2のフローチャートは、図8及び図9に例示したように、電圧Vによる劣化度D L vを考慮して、発振パルス数N pによる劣化度D L nを書き換える（上書きする）場合の「各段階の寿命関連情報のデータD（s）を作成する処理」の例である。

[0154] ステップS 2 0 1において、学習モデル作成部3 4 0は変数sの値を初期値の「1」に設定する。ここでの変数sは、発振パルス数N pをS m a x段階に分割して定義した区間を表し、発振パルス数N pによる劣化度D L nのレベルに相当する。

[0155] ステップS 2 0 2において、学習モデル作成部3 4 0は区間sのデータを読み出す。ここでは区間sにおける電圧Vのデータが読み出される。

[0156] ステップS 2 0 4において、学習モデル作成部3 4 0は電圧Vの値から劣化度D L vを算出して変数Lに保存する。例えば、電圧Vの値が1 9 k Vである場合、劣化度D L vは「6」と算出される（図8参照）。

- [0157] 次いで、ステップS 2 1 0において、学習モデル作成部3 4 0は発振パルス数 N_p による劣化度「s」と電圧Vによる劣化度「L」とを比較し、「s」よりも「L」が大きいか否かを判定する。
- [0158] ステップS 2 1 0の判定結果がY e s判定である場合（ $L > s$ ）、学習モデル作成部3 4 0はステップS 2 1 1に進む。ステップS 2 1 1において、学習モデル作成部3 4 0は区間sの寿命関連情報のデータを劣化度「L」のD（L）として保存する。
- [0159] 一方、ステップS 2 1 0の判定結果がN o判定である場合（ $L \leq s$ ）、学習モデル作成部3 4 0はステップS 2 1 2に進む。ステップS 2 1 2において、学習モデル作成部3 4 0は区間sの寿命関連情報のデータを劣化度「s」のD（s）として保存する。
- [0160] ステップS 2 1 1又はS 2 1 2の後、学習モデル作成部3 4 0はステップS 2 1 3に進む。
- [0161] ステップS 2 1 3において、学習モデル作成部3 4 0は変数sがS m a x以上であるか否かを判定する。ステップS 1 1 2の判定結果がN o判定である場合、学習モデル作成部3 4 0はステップS 2 1 4に進み、変数sの値をインクリメントしてステップS 2 0 2に戻る。ステップS 2 1 3の判定結果がY e s判定である場合、学習モデル作成部3 4 0は図1 2のフローチャートを終了して、図1 1のフローチャートに復帰する。
- [0162] 図1 3は、図1 1のステップS 1 0 4に適用される処理内容の例2を示すフローチャートである。図1 3のフローチャートは、電圧Vによる劣化度D L vとガス圧P i n iによる劣化度D L pとを考慮して、発振パルス数 N_p による劣化度D L nを書き換える場合の「各段階の寿命関連情報のデータD（s）を作成する処理」の例である。図1 3において、図1 2と共通する処理のステップには同一のステップ番号を付し、重複する説明は省略する。
- [0163] ステップS 2 0 2の後、ステップS 2 0 4 Aにおいて、学習モデル作成部3 4 0は電圧Vの値から劣化度D L vを算出して変数L 1に保存する。
- [0164] ステップS 2 0 4 Bにおいて、学習モデル作成部3 4 0はガス圧P i n i

から劣化度 DL_p を算出して変数 L_2 に保存する。

[0165] ステップ S_{206} において、学習モデル作成部 340 は L_1 と L_2 の最大値を L とする。

[0166] ステップ S_{209} において、学習モデル作成部 340 は「 s 」と「 L 」を比較し、「 L 」が大きいかなかを判定する。

[0167] ステップ S_{209} の判定結果が Yes 判定である場合 ($L > s$)、学習モデル作成部 340 はステップ S_{211} に進む。例えば、 $s = 1$ の場合に $L = 6$ であればステップ S_{210} にて Yes 判定となり、ステップ S_{211} に進む。一方、ステップ S_{209} の判定結果が No 判定である場合 ($L \leq s$)、学習モデル作成部 340 はステップ S_{212} に進む。以後のステップ $S_{211} \sim$ ステップ S_{214} は図 12 と同様である。

[0168] 図 14 は、図 11 のステップ S_{104} に適用される処理内容の例 3 を示すフローチャートである。図 14 のフローチャートは、電圧 V とガス圧 P_{ini} とを含む合計 n 個の劣化パラメータを考慮して、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n を書き換える場合の「各段階の寿命関連情報のデータ $D(s)$ を作成する処理」の例である。図 14 において、図 13 と共通する処理のステップには同一のステップ番号を付し、重複する説明は省略する。

[0169] 図 14 におけるステップ S_{204B} の後のステップ S_{205} において、任意の単一パラメータの値又はパラメータの組み合わせにより、 n 個のラベルを作成し、ラベル L_n を付与する。ステップ S_{205} の処理は、劣化度を評価する単一パラメータ又はパラメータの組み合わせの種類数に応じて任意の回数繰り返し実施される。なお、ステップ S_{204A} とステップ S_{204B} は、ステップ S_{205} の中で実施されてもよい。電圧 V やガス圧 P_{ini} は劣化度を評価する単一パラメータの例である。

[0170] ステップ S_{205} の後、ステップ S_{207} において、学習モデル作成部 340 は $L_1 \sim L_n$ のうちの最大値を L とする。その後のステップ S_{209} 、ステップ $S_{211} \sim 214$ は図 13 と同様である。

[0171] 5. 2. 7 複数のパラメータを組み合わせで1つのパラメータに変換す

る例

電圧 V やガス圧 P_{ini} などの寿命関連パラメータは、それぞれ単独で（単一パラメータとして）劣化度の評価に用いてもよいが、複数のパラメータを組み合わせで新たな（別の）パラメータを定義して、この新たなパラメータの値に基づいて劣化度を評価してもよい。

[0172] 複数の r 個の値（ r 次元）を組み合わせで1つのパラメータを導き出すことができる。複数のパラメータから1つのパラメータに変換する方法としては、例えば、 r 個の値から四則演算によって1つの値を求める変換式を用いる方法、演算に係数を使う方法、次元削減など、様々な方法を適用し得る。

[0173] 例えば、電圧 V とガス圧 P_{ini} という2つの値から新しい特徴量を表す値1～100へ変換する。この時、変換後の値1～100を10段階に区切り、各々に劣化度1～10を付与することが考えられる。2つの値と10段階のラベルとの関係の例を図15及び図16に示す。

[0174] 図15は、電圧 V とガス圧 P_{ini} の2つの値とラベルとの相関性が直線的な場合の例である。図15における横軸は発振パルス数 N_p 又はガス圧 P_{ini} による劣化度を表し、縦軸は電圧 V による劣化度を表す。図15に示す10行×10列のマトリクスの各セルに表示された数値は、2つのパラメータの値の組み合わせから導き出される新しい特徴量に対して付与される10段階のラベルを表している。

[0175] 図16は、電圧 V がラベルに与える影響は少なく、ガス圧 P_{ini} の影響が多い場合の例である。図16のように、電圧 V による劣化度よりもガス圧 P_{ini} による劣化度の評価を重視して、これら2つのパラメータの組み合わせによる劣化度のラベルを付与するように新しい特徴量を定義してもよい。

[0176] 5. 2. 8 データ $D(s)$ が複数のデータ件数を含む場合の説明

学習に使用するデータの取得条件として、例えば、下記のような場合を想定する。

[0177] [条件1] 学習に使用するデータ一式を1日に1回取得する。ここでいう

「データ式」とは、レーザ装置 10 の発振パルス数 N_p 、電圧 V 、ガス圧 P_{ini} などの各種のパラメータのデータを含む。

[0178] 条件 2 毎日同じ発振パルス数でレーザ装置 10 を使用した。

[0179] 条件 3 レーザチャンバ 100 が使用開始から 500 日で交換された。

[0180] 条件 4 交換までの 500 日間稼働したレーザチャンバ 100 について、発振パルス数 N_p で稼働期間を 10 等分して、区間ごとに発振パルス数 N_p による劣化度のラベルを付与するものとする。

[0181] 条件 1 ～ 4 を満たす場合のデータ件数の数え方は、次のようになる。すなわち、データ D 全体のデータ件数は 500 件である。

[0182] 条件 2 及び条件 4 から劣化度 1 ～ 10 のそれぞれのラベル s ($s = 1 \sim 10$) に含まれるデータ件数は 50 件である。 $D(1)$ 、 $D(2) \cdots D(10)$ のそれぞれにはデータ件数 50 件が含まれ、 $D(s)$ の全体、つまりデータ D 全体で 500 件となる。

[0183] 図 17 は、1 つの劣化度の区間に複数のデータが含まれるイメージを示すグラフである。図 17 の横軸は発振パルス数を表し、縦軸は寿命に関連する何かしらのパラメータのデータである。横軸は、発振パルス数に応じて 10 段階に等分割され、劣化度 1 ～ 10 の区間が定められている。図 17 には、図示を簡略化するために、1 つの劣化度の区間に 10 件のデータが含まれる例を示すが、1 つの区間に含まれるデータ件数はこの例に限らない。

[0184] 上述の条件 1 ～ 4 を満たす想定例の場合には、既述のように 1 つの区間に 50 件のデータが含まれる。なお、1 つの区間に 100 件、あるいは 1000 件など、さらに多数のデータ件数が含まれてもよい。

[0185] 学習時において、全データ D から任意の件数をランダムサンプリングして学習してもよい。例えば、総データ件数が 500 件である場合に、1 つの劣化度ごとに順番に学習するのではなく、全データ D の中から様々な劣化度のデータをランダムに所定件数（例えば、50 件）を重複なく抜き出して、10 回学習する。

[0186] また、劣化度のラベルの書き換えに際しては、同じ区間内の複数のデータ

を一斉に同じラベルに書き換えるのではなく、区間内の個々のデータについて、つまり、全データDに対してそれぞれ、電圧Vやガス圧 P_{ini} を基に劣化度を書き換えることが好ましい。

[0187] 図18は、図7のステップS48に適用される処理内容の例2を示すフローチャートである。図18は、学習モデルの作成サブルーチンの例2を示す。図11で説明したフローチャートの代わりに、図18に示すフローチャートを適用することができる。

[0188] 図18に示すステップS102及びステップS104は、図11と同様である。なお、図18のステップS104におけるデータD(s)は、sが1からSmaxまでの全てのデータを含む。

[0189] ステップS104の後のステップS116において、学習モデル作成部340は変数nを初期値としての「1」に設定し、変数mを「1000」に設定する。ここでの変数nは後述する処理のループ回数を示す。変数mは全データDの中から学習単位として抜き出すデータ件数を表す。m=1000の場合は、1000件毎にまとめて学習することを意味する。つまり、mはミニバッチのバッチサイズと理解してよい。mは総データ件数よりも少ない任意の数であってよい。ここでは、全データDの中からランダムに学習用のサンプル（データ）を1000件ずつ抜き出して、1000件のミニバッチの単位で学習を進める例を説明する。

[0190] ステップS117において、学習モデル作成部340はデータDからm件をランダムに抜き出す。このとき、一度抜き出したものは重複して抜き出さないものとする。m件の中には、様々な劣化度のデータが混在し得る。なお、ここでのデータDとは、D(1)、D(2)・・・D(Smax)を含む全てのデータの集合である。

[0191] ステップS118において、学習モデル作成部340は各D(s)のデータを呼び出して学習モデルに入力する。

[0192] ステップS120において、学習モデル作成部340は学習モデルの出力がレベルsとなる確率が上がるように学習モデルのパラメータを変更する。

学習モデルは、後述するニューラルネットワークモデルであって、教師ありデータによって、このモデルのパラメータを変更し、新しい学習モデルを作成する。

[0193] ステップS 1 2 2において、学習モデル作成部340は n と m の積が N 以上であるか否かを判定する。 N はデータ D の総データ件数である。ステップS 1 2 2の判定結果がNo判定である場合、学習モデル作成部340はステップS 1 2 4に進み、 n の値をインクリメントしてステップS 1 1 7に戻る。ステップS 1 2 2の判定結果がYes判定である場合、学習モデル作成部340は図18のフローチャートを終了して、図7のフローチャートに復帰する。つまり、ステップS 1 1 2の判定結果がYes判定になると、学習モデルは、今回の交換された消耗品の結果を反映した新しい学習モデルに更新される。

[0194] なお、図18のフローチャートでは、1エポックで学習を終了するフローチャートとなっているが、エポック数を2以上の値に設定するなどして、ステップS 1 1 6～ステップS 1 2 2をさらに複数回繰り返してもよい。

[0195] 図19は、図18のステップS 1 0 4に適用される処理内容の例を示すフローチャートである。図19のフローチャートは、図8及び図9に例示したように、電圧 V による劣化度 DL_v を考慮して、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n を書き換える場合の「各段階の寿命関連情報のデータ $D(s)$ を作成する処理」の例である。

[0196] 図19のステップS 2 5 1において、学習モデル作成部340はデータ番号を表すインデックス k を初期値の「1」に設定する。ステップS 2 5 2以降の処理はデータ D のデータセットの全データに対してループする。

[0197] ステップS 2 5 2において、学習モデル作成部340はデータ番号「 k 」のデータを読み出す。

[0198] ステップS 2 5 3において、学習モデル作成部340は発振パルス数 N_p による劣化度 s を算出する。

[0199] ステップS 2 5 4において、学習モデル作成部340は電圧 V の値から劣

化度 $D_L v$ を算出して変数 L に保存する。

[0200] ステップ $S260$ において、学習モデル作成部 340 は「 s 」と「 L 」を比較し、「 s 」よりも「 L 」が大きいか否かを判定する。ステップ $S260$ の判定結果が Yes 判定である場合、学習モデル作成部 340 はステップ $S261$ に進む。ステップ $S261$ において、学習モデル作成部 340 はデータ番号「 k 」の寿命関連情報のデータを劣化度「 L 」のデータ $D(L)$ として保存する。

[0201] 一方、ステップ $S260$ の判定結果が No 判定である場合、学習モデル作成部 340 はステップ $S262$ に進む。ステップ $S262$ において、学習モデル作成部 340 はデータ番号「 k 」の寿命関連情報のデータを劣化度「 s 」のデータ $D(s)$ として保存する。

[0202] ステップ $S261$ 又は $S262$ の後、学習モデル作成部 340 はステップ $S263$ に進む。

[0203] ステップ $S263$ において、学習モデル作成部 340 は k の値がデータ D の総データ件数 N 以上であるか否かを判定する。ステップ $S263$ の判定結果が No 判定である場合、学習モデル作成部 340 はステップ $S264$ に進み、インデックス k の値をインクリメントしてステップ $S252$ に戻る。ステップ $S263$ の判定結果が Yes 判定である場合、学習モデル作成部 340 は図 19 のフローチャートを終了して、図 18 のフローチャートに復帰する。

[0204] 図 19 の代わりに、図 13 又は図 14 で説明したようなフローチャートに対応するフローチャートを適用してもよい。

[0205] 5. 2. 9 ニューラルネットワークモデルの例

図 20 は、ニューラルネットワークモデルの例を示す模式図である。図 20 において円はニューロンを表し、矢印の付いた直線は信号の流れを表す。図 20 の左から入力層 402 のニューロン N_{11} 、 N_{12} 、 N_{13} 、隠れ層 404 のニューロン N_{21} 、及び出力層 406 のニューロン N_{31} である。層構造を有するニューラルネットワークの層番号を i 、ニューロン番号を j として、ニ

ニューロン N_{ij} から出力される信号の強さを X_{ij} とし、信号 X_{ij} と表記する。
 i 層と $(i + 1)$ 層との間のニューロン同士の結合の重みを W_{ij} とする。

[0206] 入力層 402 のニューロン N_{11} 、 N_{12} 、 N_{13} は、それぞれ信号の強さが X_{11} 、 X_{12} 、 X_{13} の信号を出力する。隠れ層 404 のニューロン N_{21} は、入力される信号 X_{11} 、 X_{12} 、 X_{13} の重み付き信号和 ($W_{11} \times X_{11} + W_{12} \times X_{12} + W_{13} \times X_{13}$) が閾値よりも大きい場合に、信号 X_{21} を出力する。ここでの閾値を b_{21} とすると、ニューロン N_{21} は $W_{11} \times X_{11} + W_{12} \times X_{12} + W_{13} \times X_{13} - b_{21} > 0$ の場合に、信号 X_{21} を出力する。「 $-b_{21}$ 」をニューロン N_{21} のバイアスという。

[0207] ニューラルネットワークモデルのパラメータは、ニューロン間の結合の重みとバイアスを含む。

[0208] 5. 2. 10 ニューラルネットワークモデルの学習モード

図 21 は、学習モデルを作成する際のニューラルネットワークのモデルの例である。ニューラルネットワークモデル 400 は、入力層 402 と、隠れ層 404 と、出力層 406 とを含む。

[0209] 入力層 402 は n 個のニューロン $N_{11} \sim N_{1n}$ を含み、それぞれのニューロン $N_{11} \sim N_{1n}$ に、交換した消耗品の寿命関連情報の中で劣化度 s の時のログデータが入力される。

[0210] 隠れ層 404 は、 m 個のニューロン $N_{21} \sim N_{2m}$ を含み、隠れ層 404 におけるそれぞれのニューロンに対して入力層 402 のニューロン $N_{11} \sim N_{1n}$ から出力された信号が入力される。これらの入力信号それぞれに異なる重みのパラメータ $W1$ が設定可能である。ここで、重みのパラメータ $W1$ とは、隠れ層 404 の各ニューロン $N_{21} \sim N_{2m}$ に入力される信号に対するそれぞれの重みをまとめて「重みのパラメータ $W1$ 」と表記する。

[0211] 出力層 406 は、 p 個のニューロン $N_{31} \sim N_{3p}$ を含み、出力層 406 のそれぞれのニューロンに対して隠れ層 404 のニューロン $N_{21} \sim N_{2m}$ から出力された信号が入力される。出力層 406 のニューロンの個数 p は、劣化度のレベルの段階数 (S_{max}) と同数であってよい。これらの入力信号それぞ

れに異なる重みのパラメータ W_2 が設定可能である。ここで、重みのパラメータ W_2 は、出力層406の各ニューロン $N_{31} \sim N_{3p}$ に入力される信号に対するそれぞれの重みをまとめて「重みのパラメータ W_2 」と表記する。

[0212] 出力層406のニューロン $N_{31} \sim N_{3p}$ からは、劣化度 $L_v(1) \sim L_v(s) \sim L_v(S_{max})$ の確率が出力される。ここでの劣化度の確率とは、各劣化度のレベルに該当する確からしさを示すスコアを意味する。

[0213] 劣化度 s が1から S_{max} の S_{max} 段階に定義されている場合、交換した消耗品の寿命関連情報（ログデータ） $D_1(s)$ 、 $D_2(s) \cdots D_n(s)$ を入力層402にそれぞれ入力する。

[0214] それぞれの劣化度 s の入力に対して、出力層406からの出力が、 $L_v(s)$ の確率は1に近づき、その他の劣化度の確率は0に近づく結果となるように、ニューロン間のそれぞれの重みとバイアスを調整する。

[0215] 以上のようにして、教師あり機械学習によって消耗品の寿命予測を行う学習モデルが作成される。実施形態1による機械学習方法は、消耗品の寿命関連情報の入力に対して、消耗品の劣化度の予測値を出力するように学習された予測モデル（学習済みモデル）を生産する方法と理解される。

[0216] 5. 2. 11 消耗品の寿命予測部の処理例

図22は、消耗品の寿命予測部360における処理内容の例を示すフローチャートである。図22のフローチャートに示す処理及び動作は、例えば、消耗品の寿命予測部360として機能するプロセッサがプログラムを実行することによって実現される。

[0217] 図22のステップS62において、消耗品の寿命予測部360は交換予定の消耗品の現在の寿命関連情報を受信したか否かを判定する。ステップS62の判定結果がNo判定である場合、消耗品の寿命予測部360はステップS62を繰り返す。ステップS62の判定結果がYes判定である場合、消耗品の寿命予測部360はステップS64に進む。

[0218] ステップS64において、消耗品の寿命予測部360は交換予定の消耗品の現在の寿命関連情報を取得する。ステップS64にて取得する現在の寿命

関連情報は本開示における「第2の寿命関連情報」の一例である。

- [0219] ステップS 6 6において、消耗品の寿命予測部3 6 0はレーザ装置1 0の稼動関連情報を取得する。次に、ステップS 6 8において、消耗品の寿命予測部3 6 0は交換予定の消耗品の学習モデルを呼び出す。ここでは交換予定の消耗品（レーザチャンバ1 0 0、モニタモジュール1 0 8、又は狭帯域化モジュール1 0 6）に対応したファイル（ファイルA m、ファイルB m、又はファイルC m）に保存された学習モデルを呼び出す。
- [0220] そして、ステップS 7 0において、消耗品の寿命予測部3 6 0は学習モデルを使って寿命計算を行う。すなわち、消耗品の寿命予測部3 6 0は、交換予定の消耗品の現在の寿命関連情報に基づき、学習モデルを使って寿命と、余寿命と、推奨メンテナンス日とを計算する。
- [0221] ステップS 7 2において、消耗品の寿命予測部3 6 0は交換予定の消耗品の寿命と、余寿命と、推奨メンテナンス日の各データをデータ出力部3 7 0に送信する。
- [0222] ステップS 7 4において、消耗品の寿命予測部3 6 0は消耗品の予測寿命の計算を中止するか否かを判定する。ステップS 7 4の判定結果がN o判定である場合、消耗品の寿命予測部3 6 0はステップS 6 2に戻り、ステップS 6 2からステップS 7 4を繰り返す。ステップS 7 4の判定結果がY e s判定である場合、消耗品の寿命予測部3 6 0は図2 2のフローチャートを終了する。
- [0223] 図2 3は、学習モデルを使って寿命計算を行う処理のサブルーチンの例を示すフローチャートである。すなわち、図2 3は、図2 2のステップS 7 0の処理内容の例を示すフローチャートである。
- [0224] 図2 3のステップS 1 3 2において、消耗品の寿命予測部3 6 0は交換予定の消耗品の現在の寿命関連情報を学習モデルに入力する。
- [0225] ステップS 1 3 4において、消耗品の寿命予測部3 6 0は学習モデルから各劣化度L v (1) ~ L v (S m a x) の確率を出力する。
- [0226] ステップS 1 3 6において、消耗品の寿命予測部3 6 0は劣化度の確率分

布から現在の消耗品の劣化度 s を判定する。劣化度 s の判定方法の第 1 例として、例えば、確率が一番高い劣化度を抽出してもよい。また劣化度 s の判定方法の第 2 例として、劣化度の確率分布から近似曲線を求めて、一番高い確率分布の劣化度 s を求めてもよい。第 2 例の場合は劣化度 s は整数ではなく、少数点以下の数値まで求める。第 2 例の場合は第 1 例の場合に比べて一層高精度に、消耗品の寿命と余寿命とを予測することができる。

[0227] ステップ S 1 3 8 において、消耗品の寿命予測部 3 6 0 はステップ S 1 3 6 で求めた劣化度からさらに消耗品の寿命 N_{ches} を計算する。消耗品の寿命 N_{ches} は現在の発振パルス数 N_{ch} を用いて、 $N_{ches} = N_{ch} \cdot S_{max} / s$ から計算される。なお、式中の「 $\cdot$ 」は乗算を表す。

[0228] ステップ S 1 4 0 において、消耗品の寿命予測部 3 6 0 はステップ S 1 3 6 で求めた劣化度からさらに消耗品の余寿命 N_{chre} を計算する。消耗品の余寿命 N_{chre} は現在の発振パルス数 N_{ch} を用いて、 $N_{chre} = N_{ches} - N_{ch}$ から計算される。

[0229] ステップ S 1 4 2 において、消耗品の寿命予測部 3 6 0 は消耗品の推奨メンテナンス日 D_{rec} を計算する。推奨メンテナンス日 D_{rec} は、 $D_{rec} = D_{pre} + N_{chre} / N_{day}$ から計算される。

[0230] ステップ S 1 4 2 の後、消耗品の寿命予測部 3 6 0 は図 2 3 のフローチャートを終了し、図 2 2 のフローチャートに復帰する。

[0231] 5. 2. 1 2 学習モデルを使って消耗品の寿命を計算する処理の例

図 2 4 は、作成した学習モデルを使用してレーザチャンバ 1 0 0 の寿命及び余寿命を計算する例を示す。現在運転中のレーザチャンバ 1 0 0 の予測寿命を計算する場合に、消耗品の寿命予測部 3 6 0 は現在のレーザチャンバ 1 0 0 の寿命関連情報を取得する。ここでは、現在のレーザチャンバ 1 0 0 の発振パルス数 N_{ch} のデータを取得する。

[0232] 次に、作成された学習モデルに、現在のレーザチャンバ 1 0 0 の寿命関連情報を入力すると、複数段階の各劣化度 $L_v(1) \sim L_v(10)$ である確率が計算される。図 2 5 に、10 段階の劣化度毎の確率の例を示す。図 2 5

の例では劣化度 7 である確率が一番高いと判定される。

[0233] この場合、現在運転中のレーザチャンバ 100 の予測寿命 N_{ches} は以下の式 1 で求められる。

[0234] $N_{ches} = N_{ch} \cdot 10 / 7$ (式 1)

余寿命 N_{chre} は、以下の式 2 で求められる。

[0235] $N_{chre} = N_{ches} - N_{ch} = N_{ch} \cdot 3 / 7$ (式 2)

5. 2. 13 ニューラルネットワークモデルの寿命予測モード

図 26 は、学習済みのニューラルネットワークモデル 400 によって消耗品の寿命を予測する処理の例である。ニューラルネットワークモデル 400 のネットワーク構造は、図 21 と同じ構成である。図 26 において、ニューロン間の重みのパラメータ $W1$ 及び $W2$ は、図 21 で説明した学習モードによって適正化された値が設定されている。

[0236] 現在の消耗品について寿命予測を行う場合、現在の消耗品の寿命関連情報(ログデータ) $D1, D2 \dots Dn$ を入力層 402 にそれぞれ入力する。その結果、出力層 406 からの劣化度 $L_v(1) \sim L_v(S_{max})$ のそれぞれの確率が出力される(図 25 参照)。

[0237] 5. 2. 14 その他

図 21 及び図 26 ではニューラルネットワークモデル 400 の隠れ層 404 が 1 層であるの場合の例を示したが、これに限定されることなく、隠れ層 404 が複数層あってもよい。

[0238] 本実施形態では、教師あり学習による機械学習の例を示したがこの例に限定されることなく、教師なし学習による機械学習を行ってもよい。例えば、入力データを次元削減して、それらのデータセットにある特徴を似たもの同士にクラスタリングすることができる。この結果を使って、何らかの基準を設けてそれを最適にするような出力の割り当てを行うことで、出力の予測を実現することができる。

[0239] 5. 2. 15 データ出力部の処理例

図 27 は、データ出力部 370 における処理内容の例を示すフローチャー

トである。図 27 のフローチャートに示す処理及び動作は、例えば、データ出力部 370 として機能するプロセッサがプログラムを実行することによって実現される。

[0240] ステップ S 82 において、データ出力部 370 は交換予定の消耗品の寿命データを受信したか否かを判定する。ステップ S 82 の判定結果が N o 判定である場合、データ出力部 370 はステップ S 82 を繰り返す。ステップ S 82 の判定結果が Y e s 判定である場合、データ出力部 370 はステップ S 84 に進む。

[0241] ステップ S 84 において、データ出力部 370 は交換予定の消耗品の寿命と、余寿命と、推奨メンテナンス日の各データを読み込む。

[0242] ステップ S 86 において、データ出力部 370 は交換予定の消耗品の寿命と、余寿命と、推奨メンテナンス日の各データを送信する。データの送信先は、レーザ装置用管理システム 206 及び／又は半導体工場管理システム 208 であってよい。また、データの送信先は、ネットワーク 210 に接続されている図示しない端末装置などであってもよい。

[0243] ステップ S 88 において、データ出力部 370 はデータの送信を中止するか否かを判定する。ステップ S 88 の判定結果が N o 判定である場合、データ出力部 370 はステップ S 82 に戻り、ステップ S 82 からステップ S 88 を繰り返す。ステップ S 88 の判定結果が Y e s 判定である場合、データ出力部 370 は図 27 のフローチャートを終了する。

[0244] 5. 3 レーザチャンバの寿命関連情報

図 28～図 30 に、レーザチャンバ 100 の寿命関連情報の例を示す。レーザチャンバ 100 の寿命関連情報は、例えば、電極劣化パラメータと、パルスエネルギー安定性パラメータと、ガス制御パラメータと、運転負荷パラメータと、レーザ共振器の光学素子の劣化パラメータとを含む。なお、図 30 に示す図表の「OC」の表記は出力結合ミラーを表す。

[0245] これらの寿命関連パラメータのうちで、レーザチャンバ 100 の寿命予測を精度よく行うために少なくとも必要な寿命関連パラメータは、電極劣化パ

ラメータと、パルスエネルギー安定性パラメータと、ガス制御パラメータとである。好ましくは、さらに、運転負荷パラメータを使用することによって、寿命予測の精度が改善する可能性がある。運転負荷が高い場合、レーザチャンバ100の寿命が短くなる場合があるためである。

[0246] さらに、好ましくは、レーザ共振器の損失の指標となる狭帯域化モジュール106の劣化パラメータやレーザチャンバ100のウィンドウの劣化パラメータを使用することによって、寿命予測の精度が一層改善する可能性がある。

[0247] 電極劣化パラメータは、少なくとも放電回数を含む。放電回数は、概ねレーザチャンバ100の交換後からの発振パルス数 N_p と等しい値である。電極劣化パラメータとして、好ましくは、投入エネルギーの積算値をさらに追加してもよい。

[0248] 図1に示すようなシングルチャンバ方式のレーザ装置10の場合、スペクトル線幅と放電幅との間に相関があるので、電極劣化パラメータの1つとしてスペクトル線幅を使用してもよい。

[0249] パルスエネルギー安定性パラメータは、少なくともパルスエネルギーのばらつきを含む。さらに、パルスエネルギー安定性パラメータとして、パルスエネルギーの積算値（露光量）のばらつきを追加してもよい。

[0250] ガス制御パラメータについては、充電電圧が所定の範囲となるようにレーザチャンバ100のガス圧を制御する場合は、レーザチャンバ100のガス圧と、全ガス交換して調整発振後のレーザチャンバ100のガス圧とを少なくとも含む。

[0251] レーザチャンバ100のガスが一定制御で、充電電圧を制御する場合は、ガス制御パラメータとして、充電電圧と、全ガス交換して調整発振後の充電電圧とを少なくとも含む。好ましくは、レーザチャンバ100を交換してからのハロゲンを含むガスの注入量の積算値、又は、レーザガスの注入の積算値を追加してもよい。これにより、寿命予測精度が一層改善する可能性がある。

[0252] また、好ましくは、単位発振パルス当りのハロゲンガスを含むガスの注入量、又は、レーザガスの注入量を追加してもよい。

[0253] 運転負荷パラメータは、レーザ装置 10 から出力されるレーザ光の平均出力、又は、目標パルスエネルギーがほとんど変化しない場合は、バースト運転のデューティで代用してもよい。

[0254] 特に、露光運転中の運転負荷パラメータを使用するのがよい。半導体を作る工場では、メモリ素子を作成する場合には運転負荷が高く、ロジック関連の素子を作成する場合には運転負荷が低くなることがある。

[0255] レーザ共振器の光学素子の劣化パラメータは、ウインドウの劣化パラメータと狭帯域化モジュール 106 の劣化パラメータと出力結合ミラー 104 の劣化パラメータと、を含み、それぞれの光学素子の交換後の発振パルス数 N_p を少なくとも含む。レーザ装置 10 から出力されるパルスレーザ光のパルスエネルギーが大きく変わる場合は、2 光吸収による光学素子の劣化のパラメータである、パルスエネルギーの積算値やパルスエネルギーの二乗の積算値を使用してもよい。

[0256] 5. 4 モニタモジュールの寿命関連情報の例

図 31 は、モニタモジュール 108 の寿命関連情報の例を示す。モニタモジュール 108 の寿命は、光学素子の劣化と光センサの劣化とで決まることが多い。モニタモジュール 108 の寿命関連情報は、モニタモジュール 108 の中に配置された光学素子の劣化パラメータと、光センサの劣化パラメータと、の少なくとも 1 つを含む。

[0257] モニタモジュール 108 の光学素子の劣化パラメータは、モニタモジュール 108 の交換後の発振パルス数 N_p を少なくとも含む。レーザ装置 10 から出力されるパルスレーザ光のパルスエネルギーが大きく変わる場合は、2 光吸収による光学素子の劣化のパラメータである、パルスエネルギーの積算値やパルスエネルギーの二乗の積算値を使用してもよい。

[0258] 光センサの劣化パラメータは、光センサとしてのイメージセンサの検出光強度と、スペクトル線幅と、パルスエネルギーとその積算値と、を含む。

[0259] モニタモジュール 108 の寿命予測を行うために少なくとも必要な劣化パラメータは、イメージセンサの検出光強度である。イメージセンサに入射する光強度は、スペクトル線幅と、パルスエネルギーとによって変化するので、補助的にスペクトル線幅とパルスエネルギーの値を使用してもよい。パルスエネルギーの積算値は、イメージセンサに露光される光量に近い値となるのでこの値を使用してもよい。

[0260] [その他]

図 31 に示す例では、モニタモジュール 108 のパルスエネルギー検出器 144 に含まれる光センサは、例えば、フォトダイオードや焦電素子である。これらセンサの劣化も、モニタモジュール 108 を交換してからのパルスエネルギーの積算値で評価可能となる。目標パルスエネルギーが大きく変化しない場合は、モニタモジュール交換後の発振パルス数 N_p で代用できる。

[0261] 5. 5 狭帯域化モジュールの寿命関連情報の例

図 32 は、狭帯域化モジュール 106 の寿命関連情報の例を示す。狭帯域化モジュール 106 の寿命は、光学素子の劣化と波長アクチュエータの劣化とで決まることが多い。狭帯域化モジュール 106 の寿命関連情報は、狭帯域化モジュール 106 の中に配置された光学素子（複数のプリズムとグレーティング）の劣化パラメータと、波長アクチュエータの劣化パラメータと、波面の劣化のパラメータと、の少なくとも 1 つを含む。

[0262] 狭帯域化モジュール 106 の寿命予測にとって少なくとも必要な劣化パラメータは、狭帯域化モジュール 106 の光学素子の劣化パラメータである。好ましくは、波長アクチュエータの劣化パラメータと、波面の劣化のパラメータを追加してもよい。

[0263] 狭帯域化モジュール 106 の光学素子の劣化パラメータは、狭帯域化モジュール 106 の交換後の発振パルス数を少なくとも含む。レーザ装置 10 から出力されるパルスレーザ光のパルスエネルギーが大きく変わる場合は、2 光吸収による光学素子の劣化のパラメータである、パルスエネルギーの積算値やパルスエネルギーの二乗の積算値を使用してもよい。

- [0264] 波長アクチュエータの劣化パラメータは、波長安定性を含む。
- [0265] 波長アクチュエータが劣化して動作が悪化すると、波長制御が不安定となるため、波長安定性を使用することによって、寿命を評価できる可能性がある。
- [0266] 波面の劣化のパラメータは、スペクトル線幅を含む。レーザ装置10から出力されるパルスレーザ光のスペクトル線幅は、狭帯域化モジュール106の波面が歪むことによって太くなるので、スペクトル線幅を使用することによって、寿命を評価できる可能性がある。例えば、プリズムに合成石英を使用している場合、コンパクションによって、プリズムの透過波面が歪みスペクトル線幅が太くなる場合がある。
- [0267] 5. 6 作用・効果
- 電圧 V やガス圧 P_{ini} などのパラメータの値はレーザチャンバ100の劣化に対して明確な相関性がある。仮に、発振パルス数 N_p のみでレーザチャンバ100の劣化度を評価して、発振パルス数 N_p に対して段階的に増加する劣化度のラベルを付与しただけでは、上記の電圧 V やガス圧 P_{ini} との関連性を学習させることができない。このため、発振パルス数 N_p のみによって劣化度のラベルを付与した場合、例えば、初期からの劣化、急激な劣化、又は一時的な劣化などに対して、適切な劣化度を予測する学習モデルを作ることが困難である。
- [0268] この点、実施形態1によれば、電圧 V 及び／又はガス圧 P_{ini} などの寿命関連パラメータを使用して、発振パルス数 N_p による劣化度 DL_n をより適切な劣化度のラベルに書き換えることにより、パラメータの値と劣化度のラベルとが正しい相関性を持つ学習モデルを作ることができる。実施形態1に係る訓練データ作成方法によれば、予測精度の高い学習モデルの作成を可能にする訓練データのデータセットを得ることができる。
- [0269] 実施形態1に係る消耗品管理サーバ310によれば、レーザ装置10における交換予定の消耗品の各々に対して、その消耗品の寿命関連情報に基づいて、対応する学習モデルを使用することによって、交換予定の消耗品の各々

の寿命を精度よく予測できる。

[0270] 5. 7 その他

実施形態1では、電圧V及び／又はガス圧P i n iなどの寿命関連パラメータを使用して、発振パルス数N pによる劣化度D L nをより適切な劣化度のラベルに書き換える方法として、劣化のレベルが最も高い劣化度を付与する例を説明したが、異なる評価指標による複数の劣化度から1つの劣化度を決める方法はこの例に限らない。例えば、複数の劣化度の平均値を算出し、その平均値を実際に付与する劣化度のラベルとしてもよい。具体例として、発振パルス数N pによる劣化度D L nが2、電圧Vによる劣化度D L vが6である場合に、これらの平均値である「4」を実際に付与する劣化度のラベルとしてもよい。

[0271] また、消耗品の寿命と関連する複数のパラメータに関して重み付けを行い、それぞれのパラメータによる劣化度の加重平均を算出して、その値を実際に付与する劣化度のラベルとしてもよい。

[0272] 実施形態1では、半導体工場の露光装置用K r Fエキシマレーザの場合の例を示したが、これに限定されることなく、例えば、フラットパネルのアニール用エキシマレーザや加工用のエキシマレーザに適用してもよい。これらの場合は、狭帯域化モジュール106の代わりに、リアミラーが配置され、モニタモジュール108のスペクトル検出器146はなくてもよい。

[0273] 6. 変形例

実施形態1で説明した消耗品管理サーバ310における訓練データの作成機能と、作成した訓練データを用いた機械学習による学習モデルの作成機能と、作成した学習モデルを用いて消耗品の寿命予測の処理を行う機能とは、それぞれ別々の装置（サーバなど）で実現してもよい。

[0274] また、訓練データの作成処理と訓練データを用いた学習処理とは、一連の処理フローの中で実施してもよいし、それぞれの処理を独立に実施してもよい。

[0275] 7. プログラムを記録したコンピュータ可読媒体について

上述の各実施形態で説明した消耗品管理サーバ310として、コンピュータを機能させるための命令を含むプログラムを光ディスクや磁気ディスクその他のコンピュータ可読媒体（有体物たる非一過性の情報記憶媒体）に記録し、この情報記憶媒体を通じてプログラムを提供することが可能である。このプログラムをコンピュータに組み込み、プロセッサがプログラムの命令を実行することにより、コンピュータに消耗品管理サーバ310の機能を実現させることができる。

[0276] 上記の説明は、制限ではなく単なる例示を意図している。したがって、添付の特許請求の範囲を逸脱することなく本開示の実施形態に変更を加えることができることは、当業者には明らかであろう。

[0277] 本明細書及び添付の特許請求の範囲全体で使用される用語は、「限定的でない」用語と解釈されるべきである。例えば、「含む」又は「含まれる」という用語は、「含まれるものとして記載されたものに限定されない」と解釈されるべきである。「有する」という用語は、「有するものとして記載されたものに限定されない」と解釈されるべきである。また、本明細書、及び添付の特許請求の範囲に記載される不定冠詞「1つの」は、「少なくとも1つ」又は「1又はそれ以上」を意味すると解釈されるべきである。また、「A、B及びCの少なくとも1つ」という用語は、「A」「B」「C」「A+B」「A+C」「B+C」又は「A+B+C」と解釈されるべきである。さらに、それらと「A」「B」「C」以外のものとの組み合わせも含むと解釈されるべきである。

請求の範囲

- [請求項1] レーザ装置の消耗品の寿命を予測するための学習モデルの機械学習に使用する訓練データの作成方法であって、
- 前記消耗品の使用が開始されてから交換されるまでの期間中の異なる発振パルス数に対応して記録された前記消耗品の少なくとも1つの寿命関連パラメータのデータを含む第1の寿命関連情報を取得することと、
- 前記発振パルス数に基づき前記消耗品の第1の劣化度を定めることと、
- 前記少なくとも1つの前記寿命関連パラメータに基づき前記消耗品の第2の劣化度を定めることと、
- 前記第1の劣化度と前記第2の劣化度とに基づき前記消耗品の第3の劣化度を定めることと、
- 前記第1の寿命関連情報と前記第3の劣化度とを対応付けた訓練データを作成することと、
- を含む訓練データ作成方法。
- [請求項2] 請求項1に記載の訓練データ作成方法であって、
- 前記第1の劣化度と前記第2の劣化度のうち、劣化のレベルが高い方の劣化度を前記第3の劣化度として決定する、
- 訓練データの作成方法。
- [請求項3] 請求項1に記載の訓練データ作成方法であって、
- 前記寿命関連パラメータは、レーザチャンバに配置された放電電極に印加する電圧を含む、
- 訓練データ作成方法。
- [請求項4] 請求項1に記載の訓練データ作成方法であって、
- 前記寿命関連パラメータは、レーザチャンバのレーザガスを交換した後の初期ガス圧を含む、
- 訓練データ作成方法。

- [請求項5] 請求項 1 に記載の訓練データ作成方法であって、
 前記第 1 の寿命関連情報は、複数の前記寿命関連パラメータのデータを含み、
 前記複数の前記寿命関連パラメータのそれぞれに基づき前記寿命関連パラメータごとに前記第 2 の劣化度が定められ、
 前記寿命関連パラメータごとに定められた複数の前記第 2 の劣化度と前記第 1 の劣化度のうち、劣化のレベルが最も高い劣化度を前記第 3 の劣化度として決定する、
 訓練データ作成方法。
- [請求項6] 請求項 5 に記載の訓練データ作成方法であって、
 前記複数の寿命関連パラメータは、
 レーザチャンバに配置された放電電極に印加する電圧と、
 前記レーザチャンバのレーザガスを交換した後の初期ガス圧とを含む、
 訓練データ作成方法。
- [請求項7] 請求項 1 に記載の訓練データ作成方法であって、
 前記第 1 の寿命関連情報は、複数の前記寿命関連パラメータのデータを含み、
 前記複数の前記寿命関連パラメータの組み合わせに基づき前記第 2 の劣化度が定められる、訓練データ作成方法。
- [請求項8] 請求項 1 に記載の訓練データ作成方法であって、
 前記第 1 の寿命関連情報は、複数の前記寿命関連パラメータのデータを含み、
 前記複数の前記寿命関連パラメータに基づき異なる種類のパラメータごとに前記第 2 の劣化度が定められ、
 前記異なる種類のパラメータごとに定められた複数の前記第 2 の劣化度と前記第 1 の劣化度のうち、劣化のレベルが最も高い劣化度を前記第 3 の劣化度として決定する、

訓練データ作成方法。

[請求項9]

請求項 1 に記載の訓練データ作成方法であって、

前記第 1 の劣化度は、前記発振パルス数に応じて複数段階にレベル分けされており、前記発振パルス数が大きくなるにつれて前記消耗品の劣化のレベルが高くなるように定められる、

訓練データ作成方法。

[請求項10]

請求項 9 に記載の訓練データ作成方法であって、

前記複数段階が 10 段階である、訓練データ作成方法。

[請求項11]

請求項 9 に記載の訓練データ作成方法であって、

前記第 2 の劣化度の最大レベル値は、前記第 1 の劣化度の最大レベル値に等しい、

訓練データ作成方法。

[請求項12]

請求項 9 に記載の訓練データ作成方法であって、

前記少なくとも 1 つの寿命関連パラメータの値が所定の閾値よりも小さい値である場合の前記第 2 の劣化度が、前記第 1 の劣化度の最小レベル値以下の値となるように前記第 2 の劣化度が定義される、

訓練データ作成方法。

[請求項13]

レーザ装置の消耗品の寿命を予測するための学習モデルを作成する機械学習方法であって、

前記消耗品の使用が開始されてから交換されるまでの期間中の異なる発振パルス数に対応して記録された前記消耗品の少なくとも 1 つの寿命関連パラメータのデータを含む第 1 の寿命関連情報を取得することと、

前記発振パルス数に基づき前記消耗品の第 1 の劣化度を定めることと、

前記少なくとも 1 つの前記寿命関連パラメータに基づき前記消耗品の第 2 の劣化度を定めることと、

前記第 1 の劣化度と前記第 2 の劣化度とに基づき前記消耗品の第 3

の劣化度を定めることと、

前記第 1 の寿命関連情報と前記第 3 の劣化度とを対応付けた訓練データを作成することと、

前記訓練データを用いて機械学習を行うことにより、前記第 1 の寿命関連情報に含まれる前記寿命関連パラメータのデータから前記消耗品の劣化度を予測する前記学習モデルを作成することと、

前記作成された前記学習モデルを保存することと、
を含む機械学習方法。

[請求項14]

請求項 1 3 に記載の機械学習方法であって、

前記学習モデルは、ニューラルネットワークモデルである機械学習方法。

[請求項15]

請求項 1 3 に記載の機械学習方法を実施することによって作成された前記学習モデルを保存しておく記憶装置と、プロセッサと、を備え、

前記プロセッサは、

前記レーザ装置における交換予定の消耗品についての寿命予測処理の要求信号を受信して、前記交換予定の消耗品に関する現在の第 2 の寿命関連情報を取得し、

前記交換予定の消耗品の前記学習モデルと前記第 2 の寿命関連情報とに基づいて、前記交換予定の消耗品の寿命と余寿命とを計算し、

前記計算によって得られた前記交換予定の消耗品の寿命と余寿命とのうち少なくとも一方の情報を外部装置に通知する、
消耗品管理装置。

[請求項16]

請求項 1 5 に記載の消耗品管理装置であって、

前記プロセッサは、前記学習モデルに前記第 2 の寿命関連情報を入力し、

前記学習モデルから前記第 2 の寿命関連情報に対応する前記消耗品の劣化度のレベルの確からしさを示すスコアを取得し、

前記第2の寿命関連情報に含まれる現在の発振パルス数と前記スコアとを基に、前記交換予定の消耗品の寿命と余寿命とを算出する、消耗品管理装置。

[請求項17] プログラムが記録された非一過性のコンピュータ可読媒体であって、

前記プログラムは、コンピュータにより実行された場合に、前記コンピュータに、レーザ装置の消耗品の寿命を予測するための学習モデルの機械学習に使用する訓練データの作成機能を実現させるプログラムであり、

前記消耗品の使用が開始されてから交換されるまでの期間中の異なる発振パルス数に対応して記録された前記消耗品の少なくとも1つの寿命関連パラメータのデータを含む第1の寿命関連情報を取得する機能と、

前記発振パルス数に基づき前記消耗品の第1の劣化度を定める機能と、

前記少なくとも1つの前記寿命関連パラメータに基づき前記消耗品の第2の劣化度を定める機能と、

前記第1の劣化度と前記第2の劣化度とに基づき前記消耗品の第3の劣化度を定める機能と、

前記第1の寿命関連情報と前記第3の劣化度とを対応付けた訓練データを作成する機能と、を前記コンピュータに実現させるための命令を含む、

コンピュータ可読媒体。

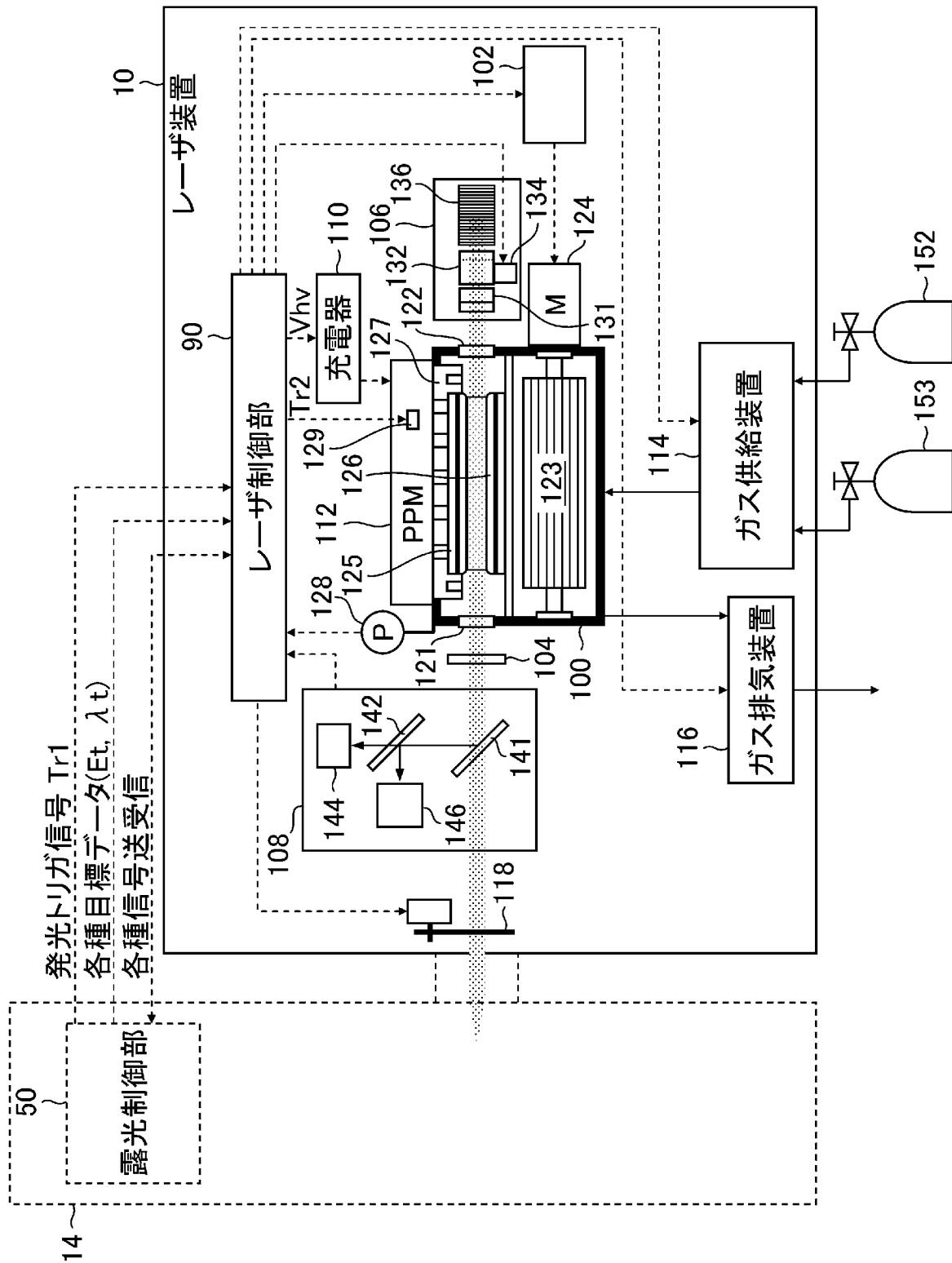
[請求項18] 請求項17に記載のコンピュータ可読媒体であって、

前記プログラムは、さらに、前記訓練データを用いて機械学習を行うことにより、前記第1の寿命関連情報に含まれるデータから前記消耗品の劣化度を予測する前記学習モデルを作成する機能と、

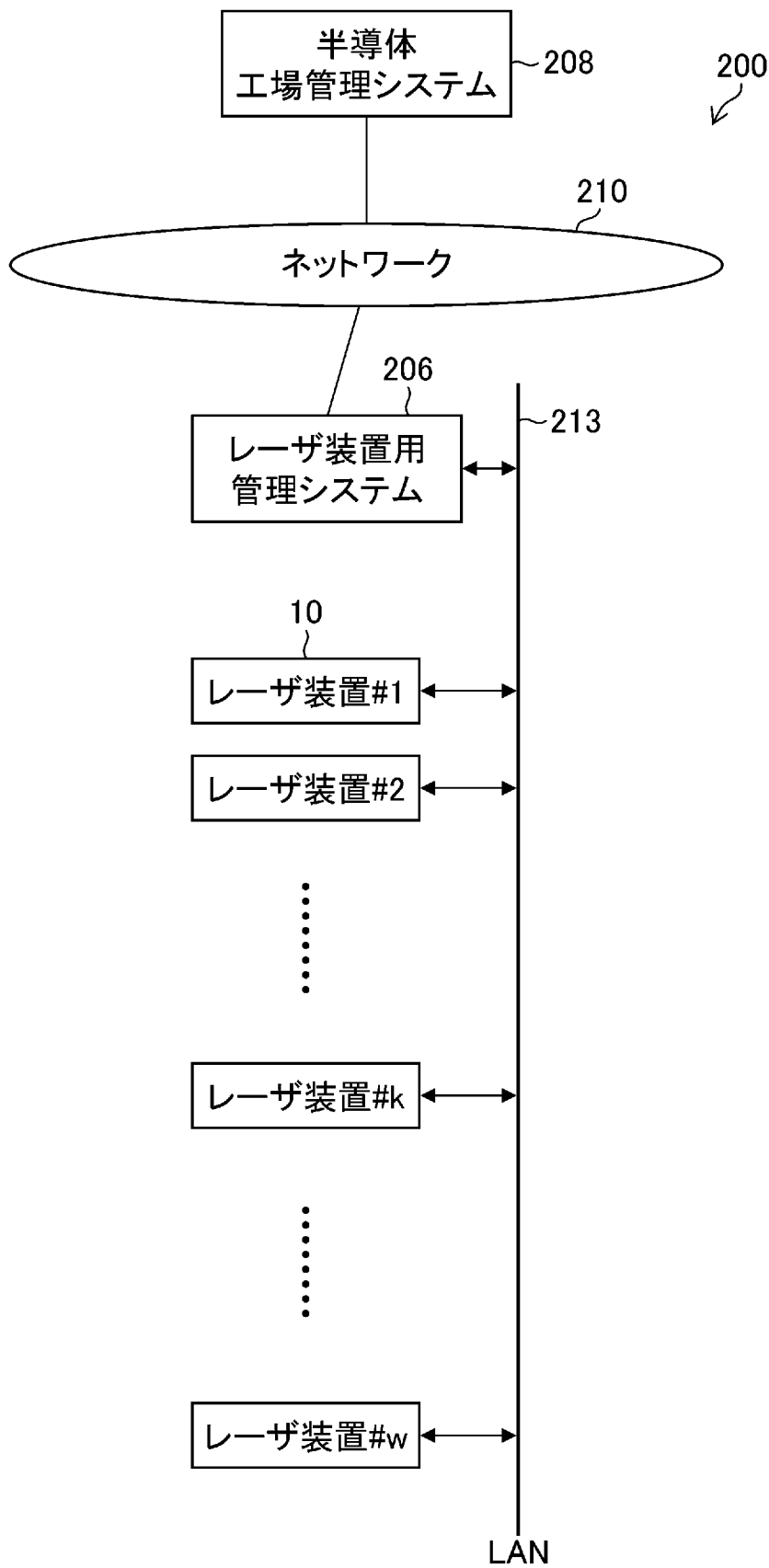
前記作成された前記学習モデルを保存する機能と、を前記コンピュ

ータに実現させるための命令を含む、
コンピュータ可読媒体。

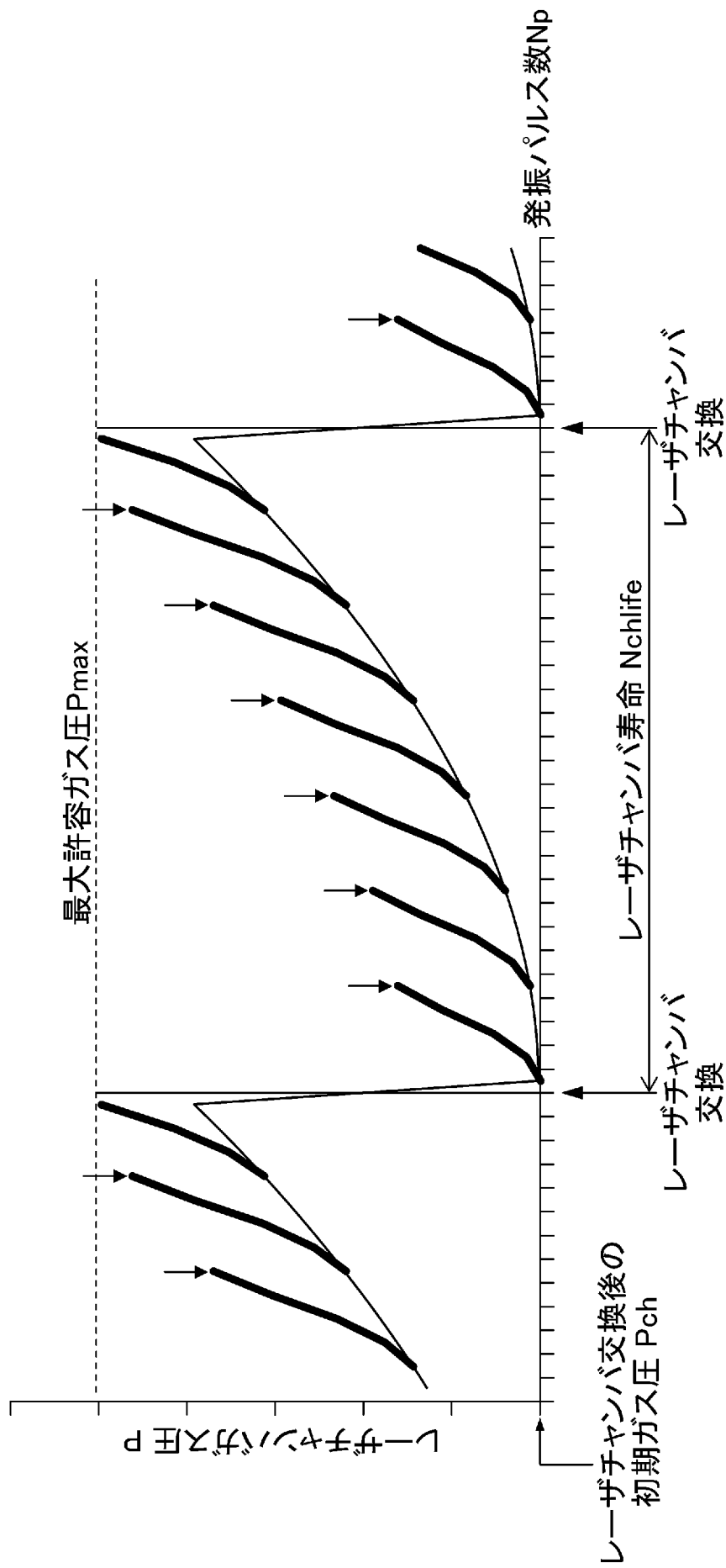
- [請求項19] 請求項18に記載のコンピュータ可読媒体に記録されたプログラム
を実行することによって作成された前記学習モデルを保存する機能と
、
 前記レーザ装置における交換予定の消耗品についての寿命予測処理
の要求信号を受信する機能と、
 前記要求信号の受信に応じて、前記交換予定の消耗品に関する現在の
第2の寿命関連情報を取得する機能と、
 前記交換予定の消耗品の前記学習モデルと前記第2の寿命関連情報
とに基づいて、前記交換予定の消耗品の寿命と余寿命とを計算する機
能と、
 前記計算によって得られた前記交換予定の消耗品の寿命と余寿命と
の情報を外部装置に通知する機能と、
 をコンピュータに実現させるためのプログラムが記録された非一過
性のコンピュータ可読媒体。



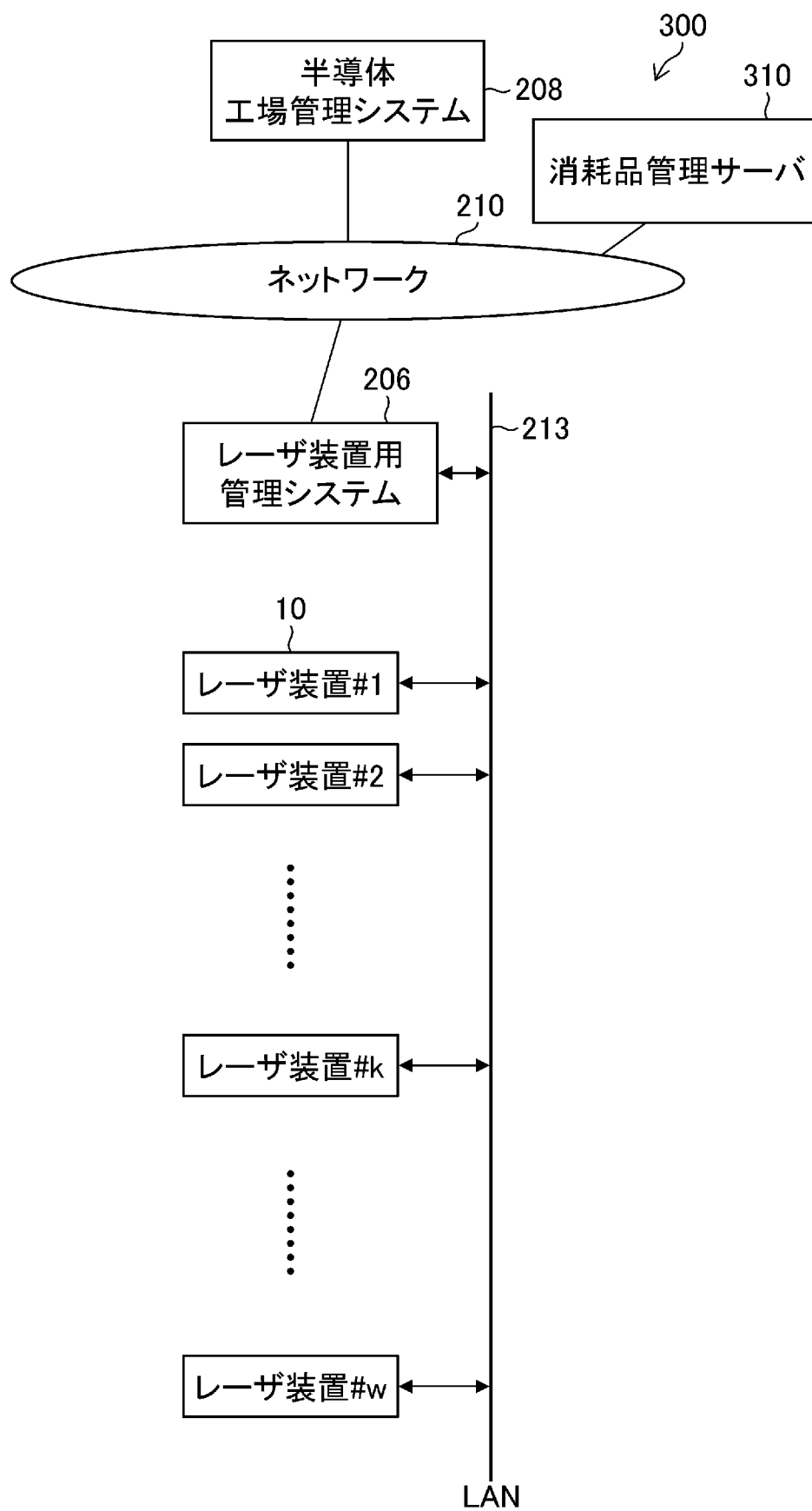
[図2]



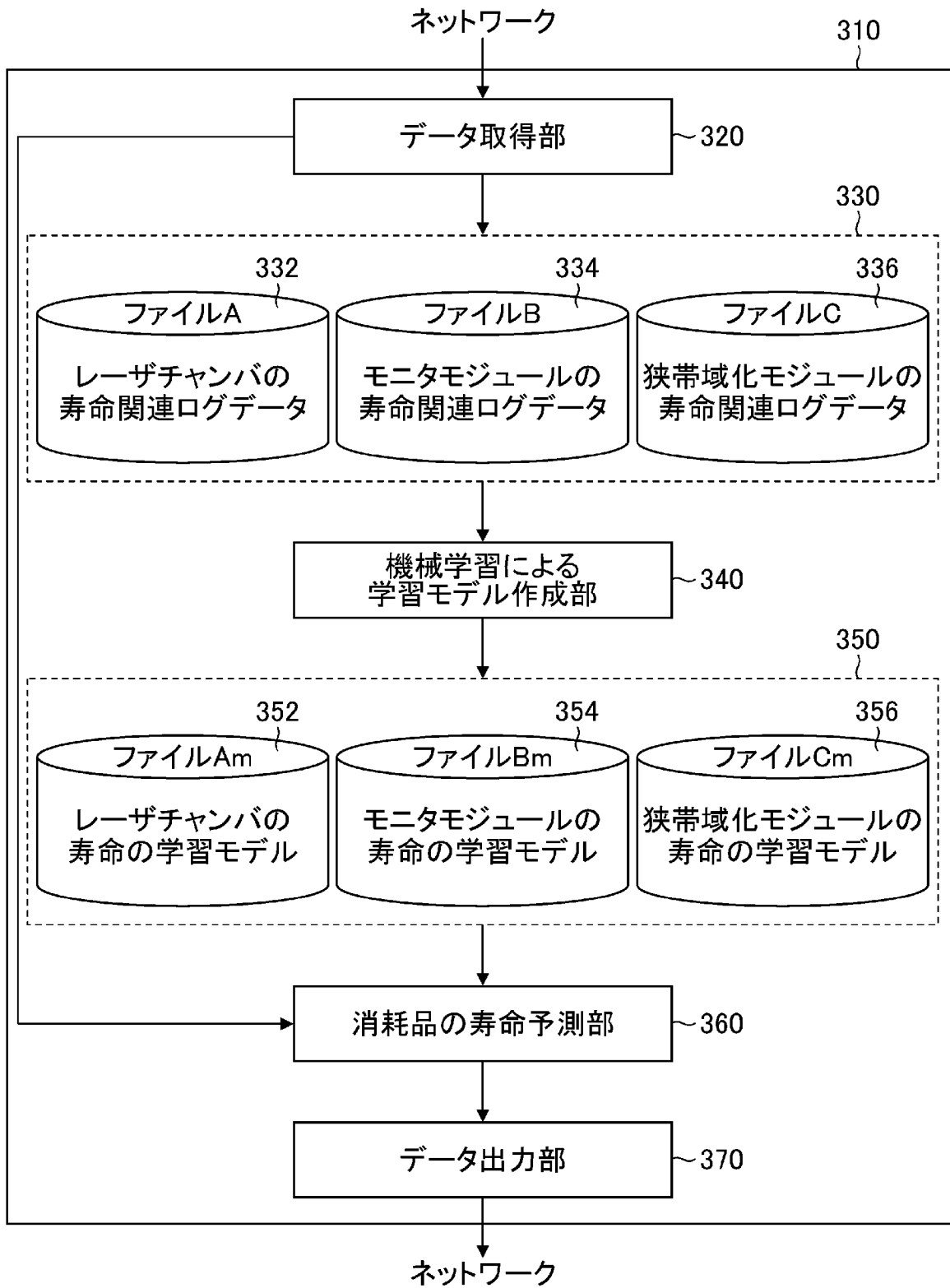
[図3]



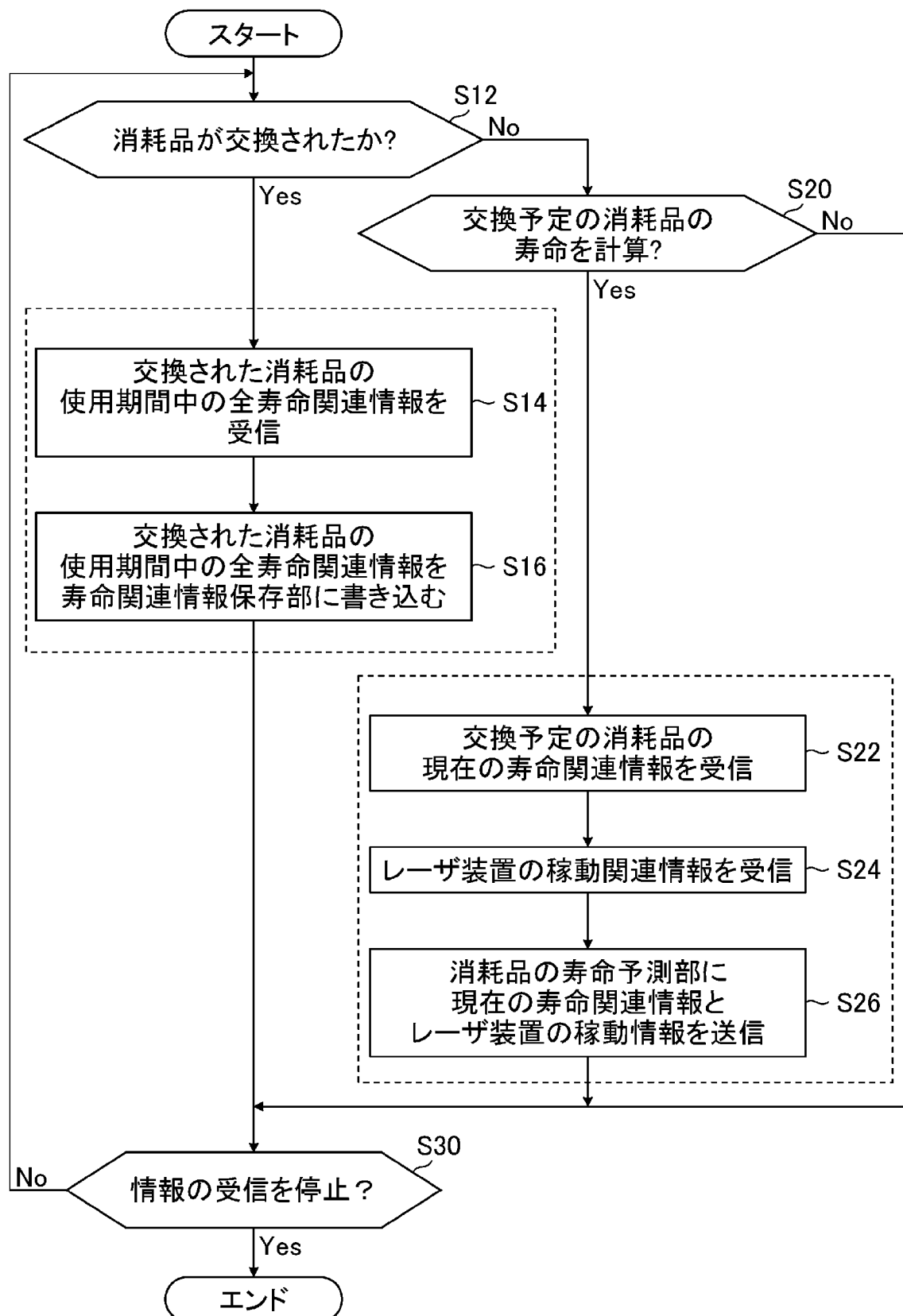
[図4]



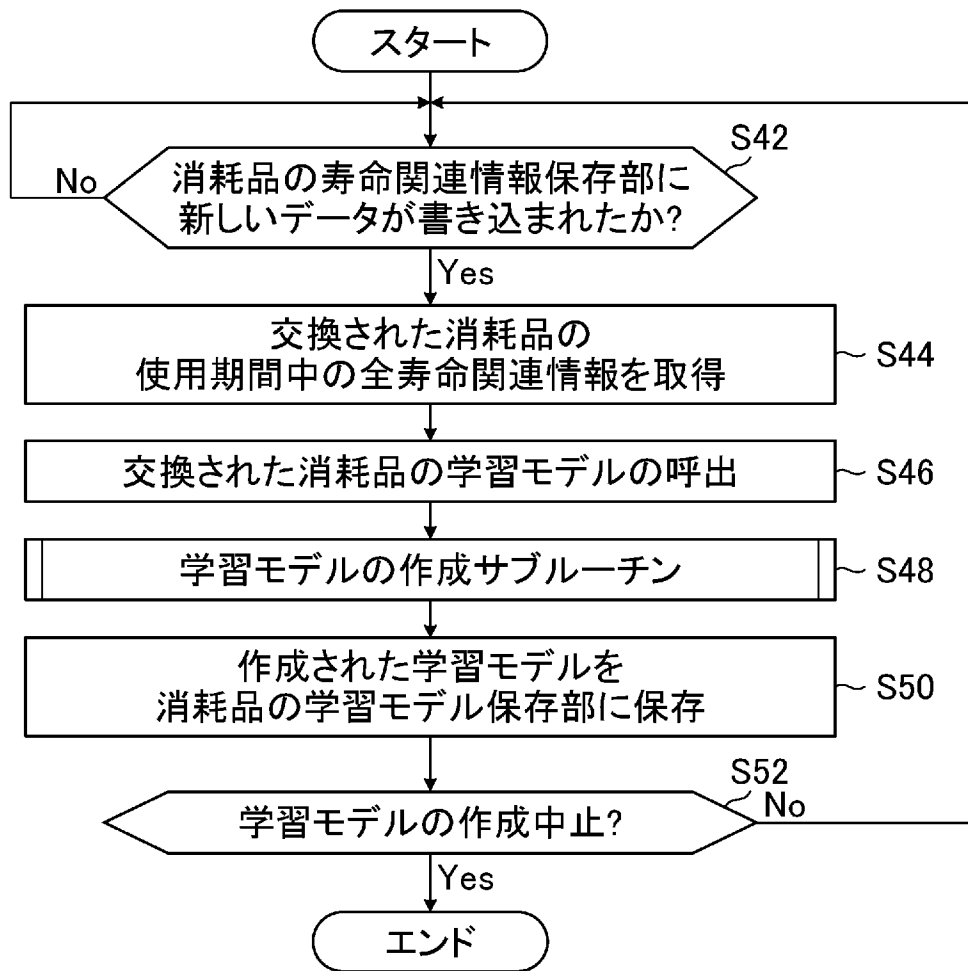
[図5]



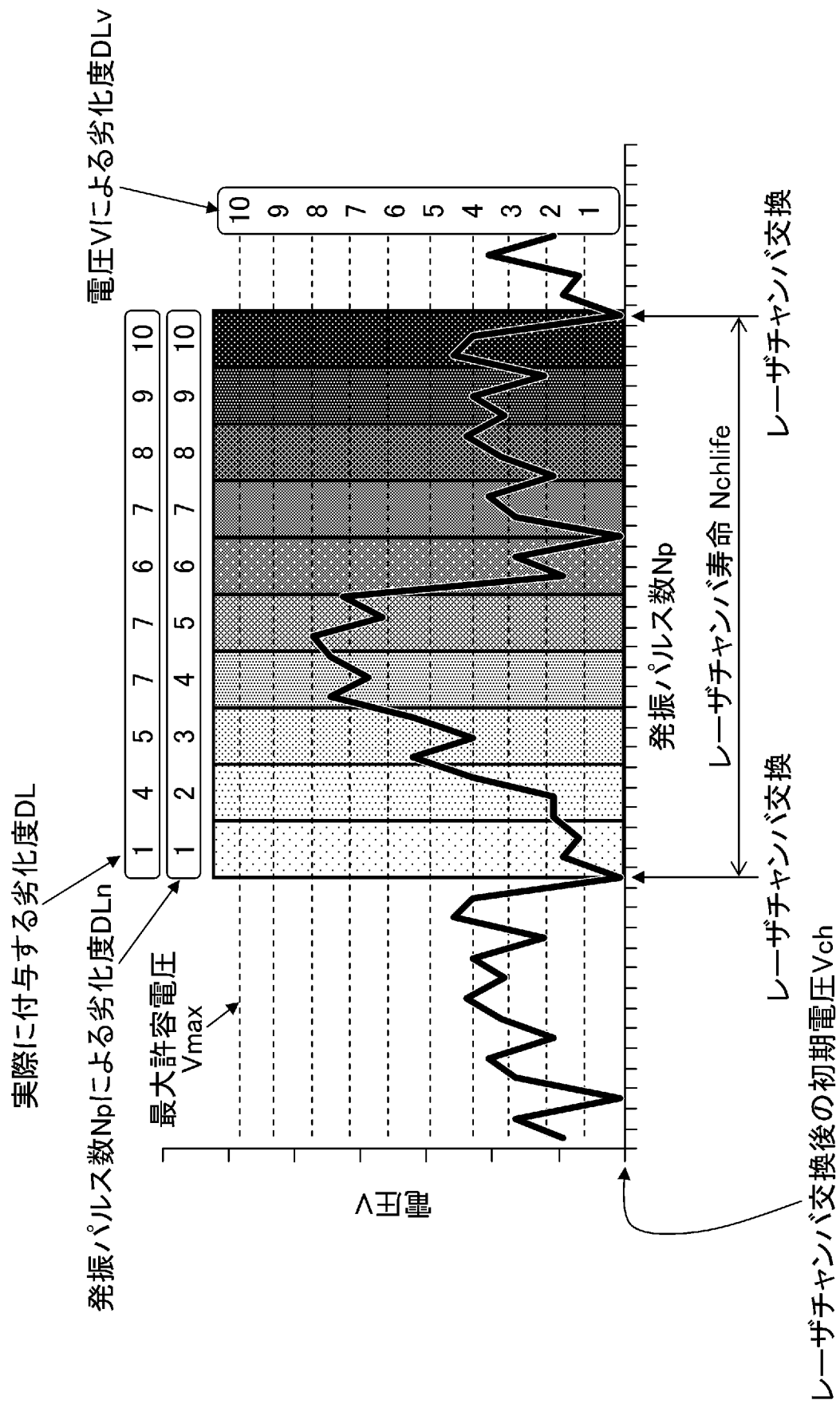
[図6]



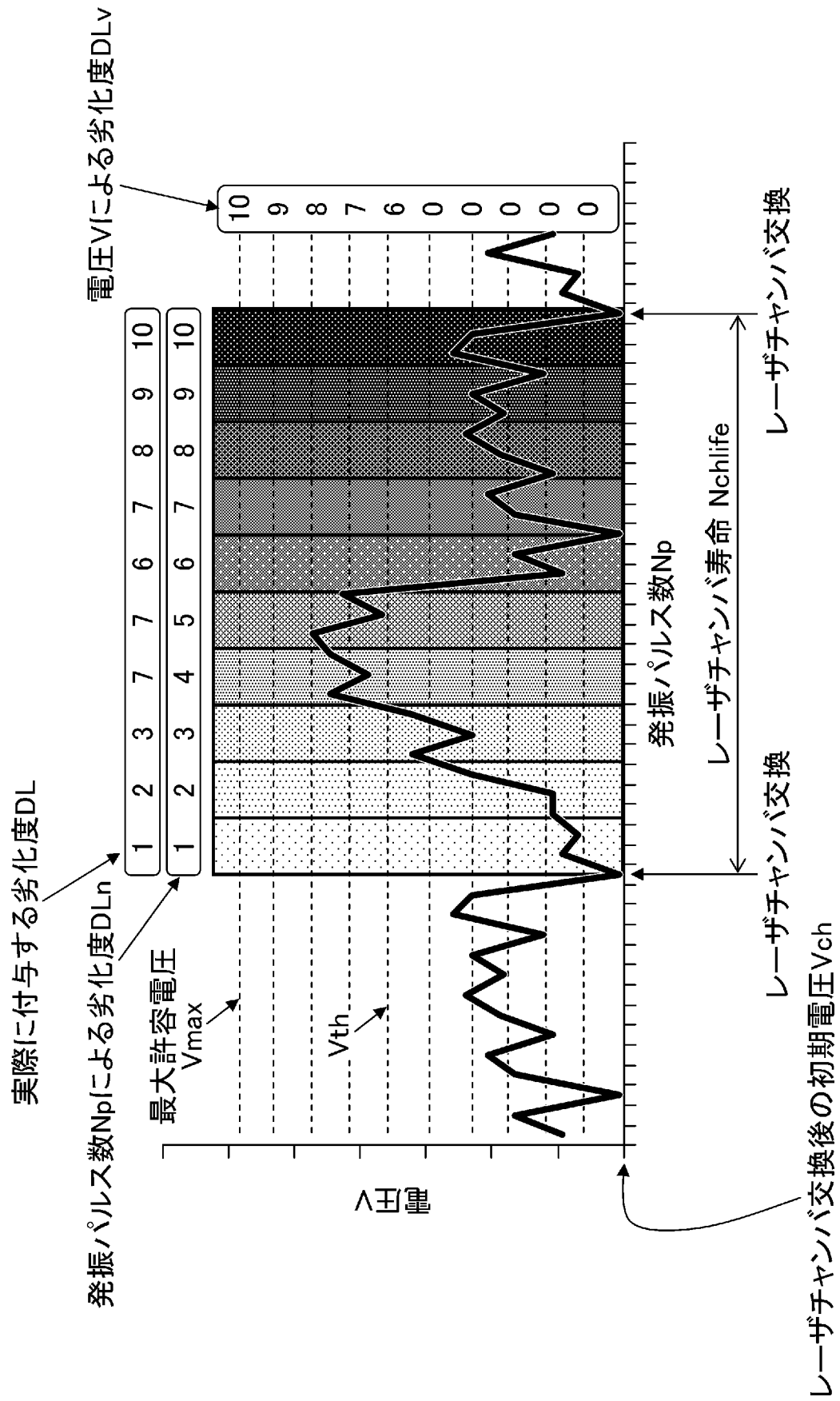
[図7]



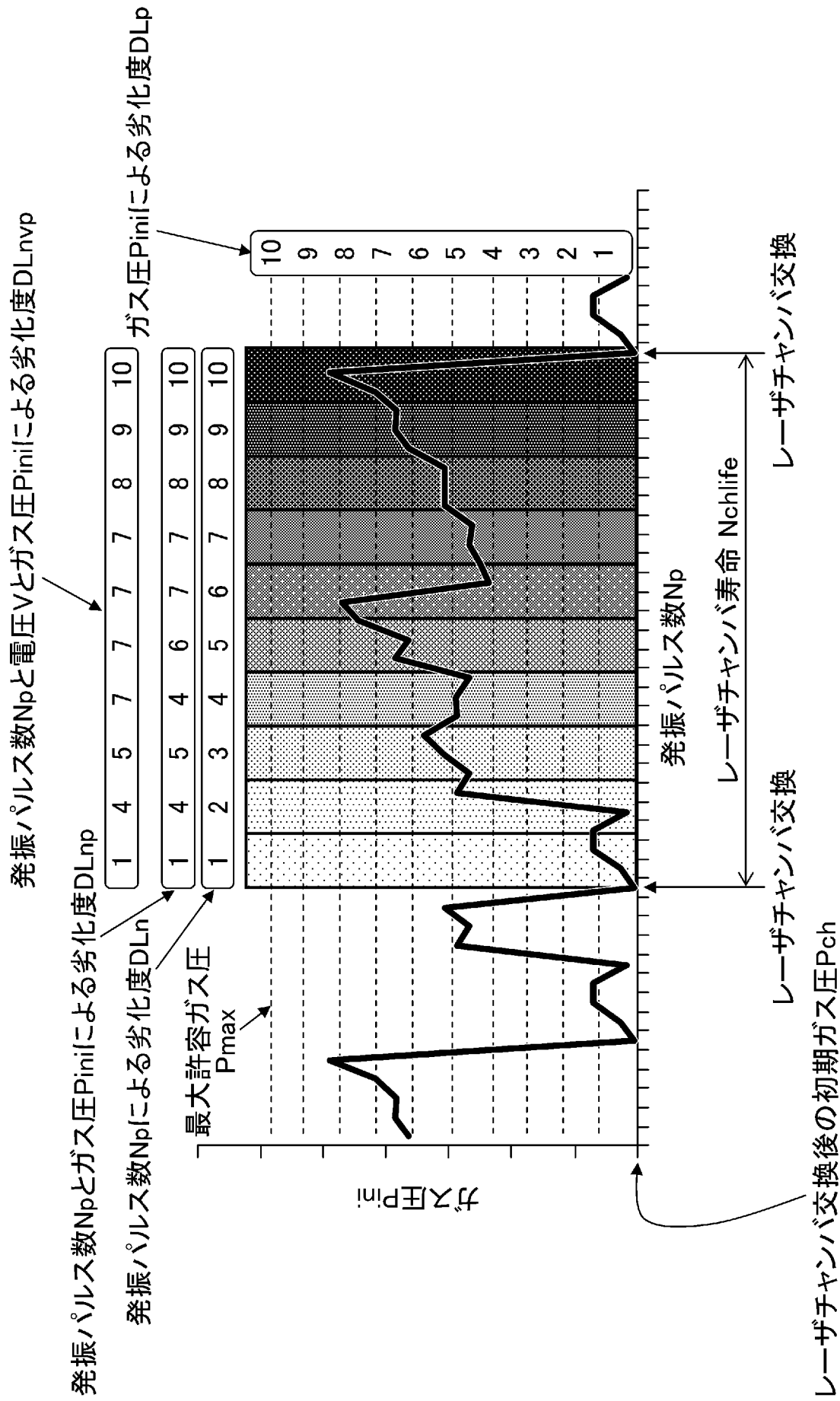
[図8]



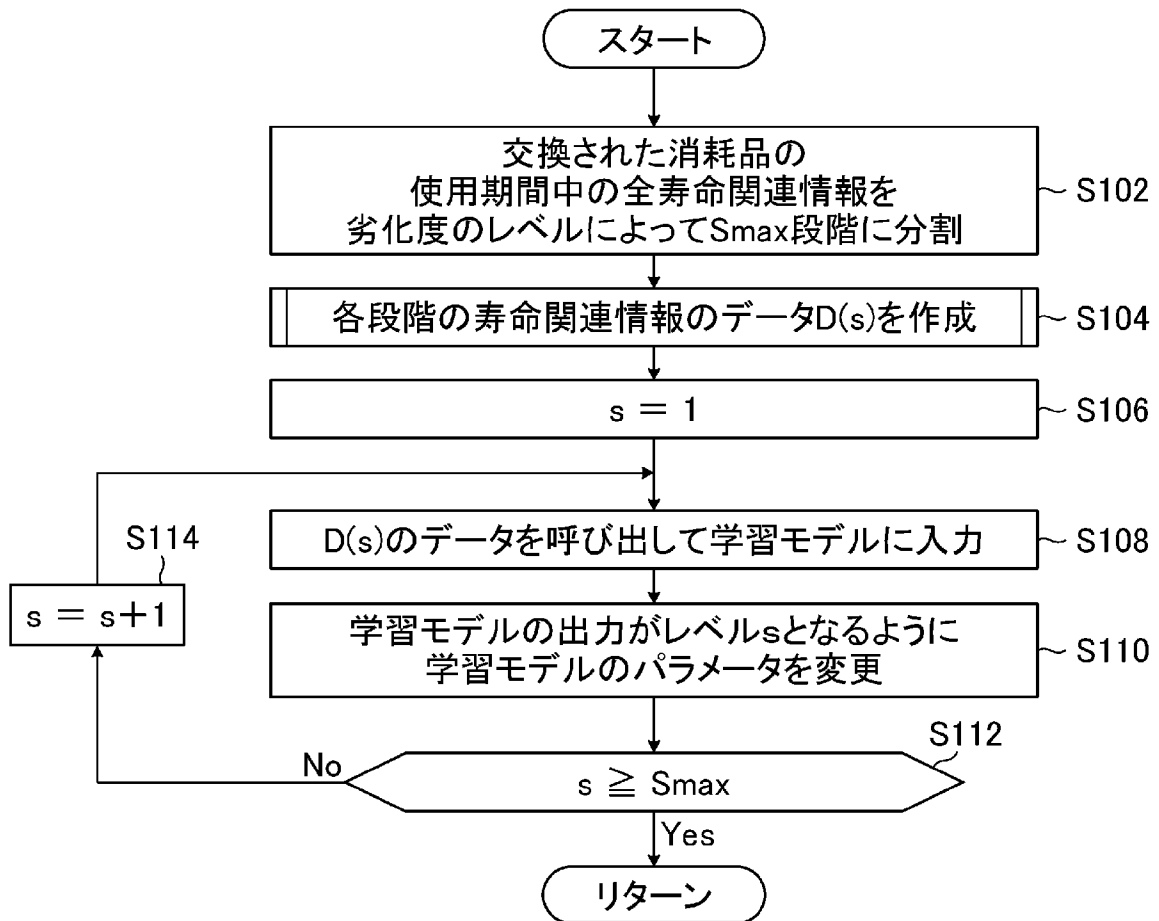
[図9]



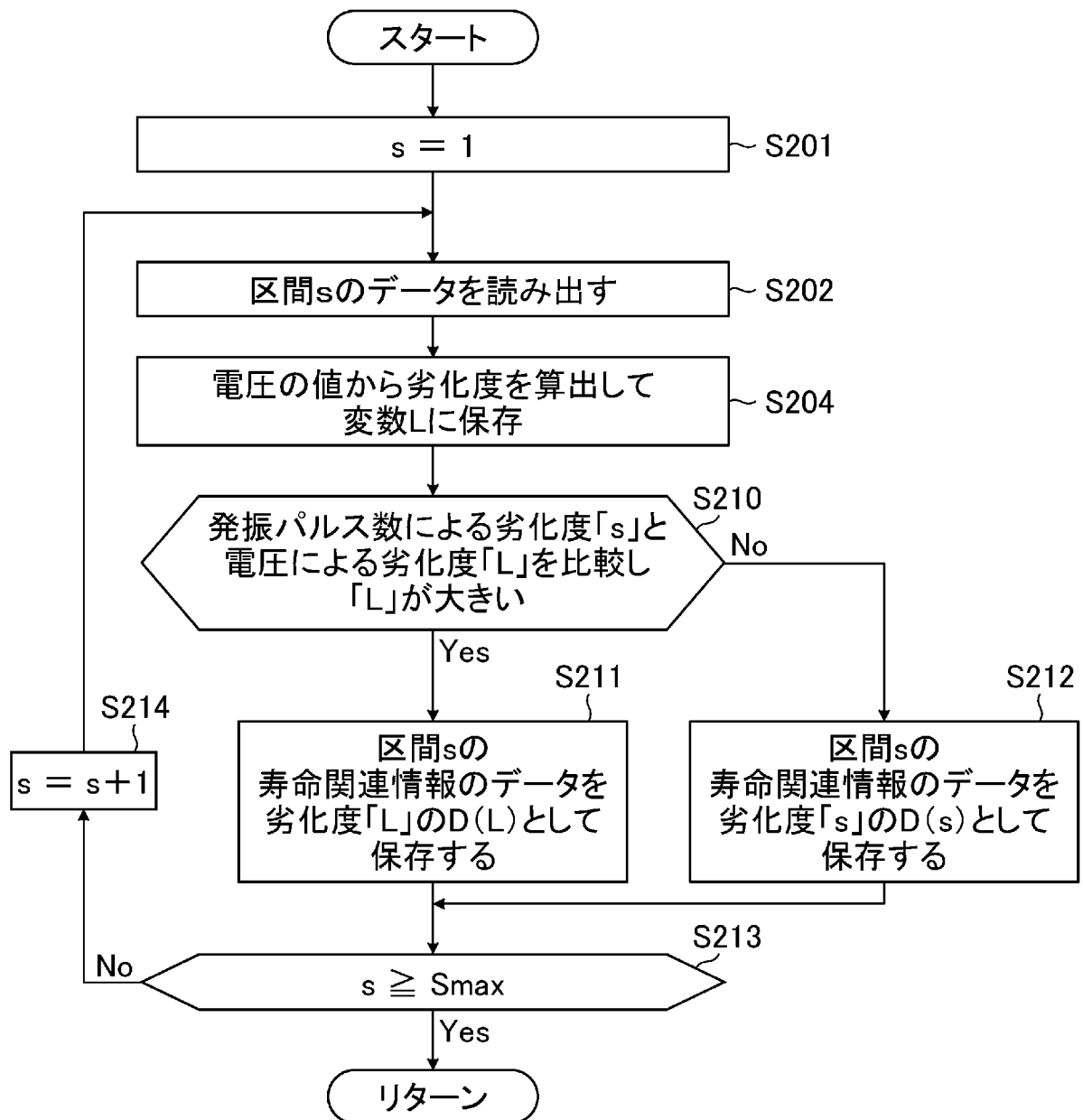
[図10]



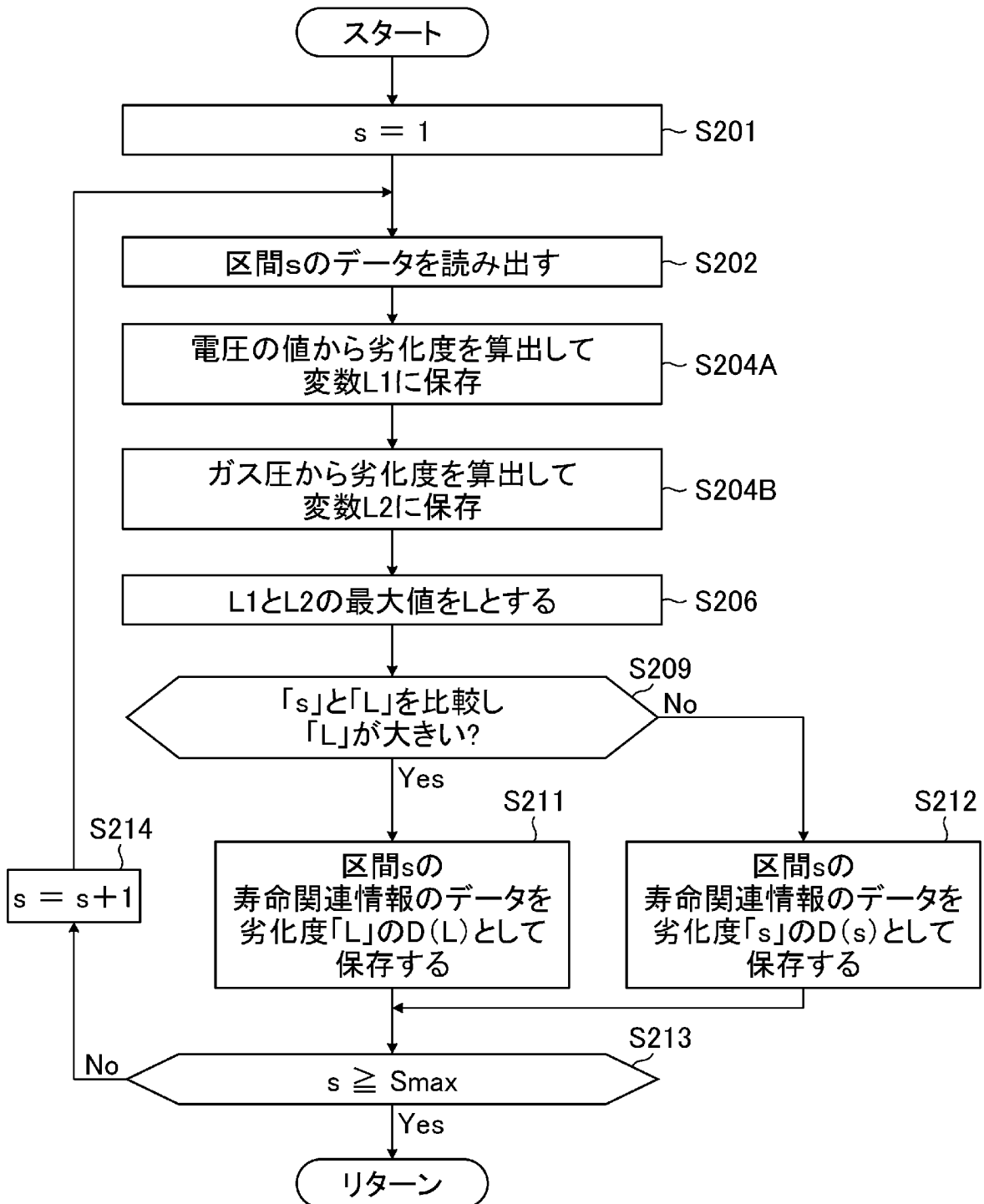
[図11]



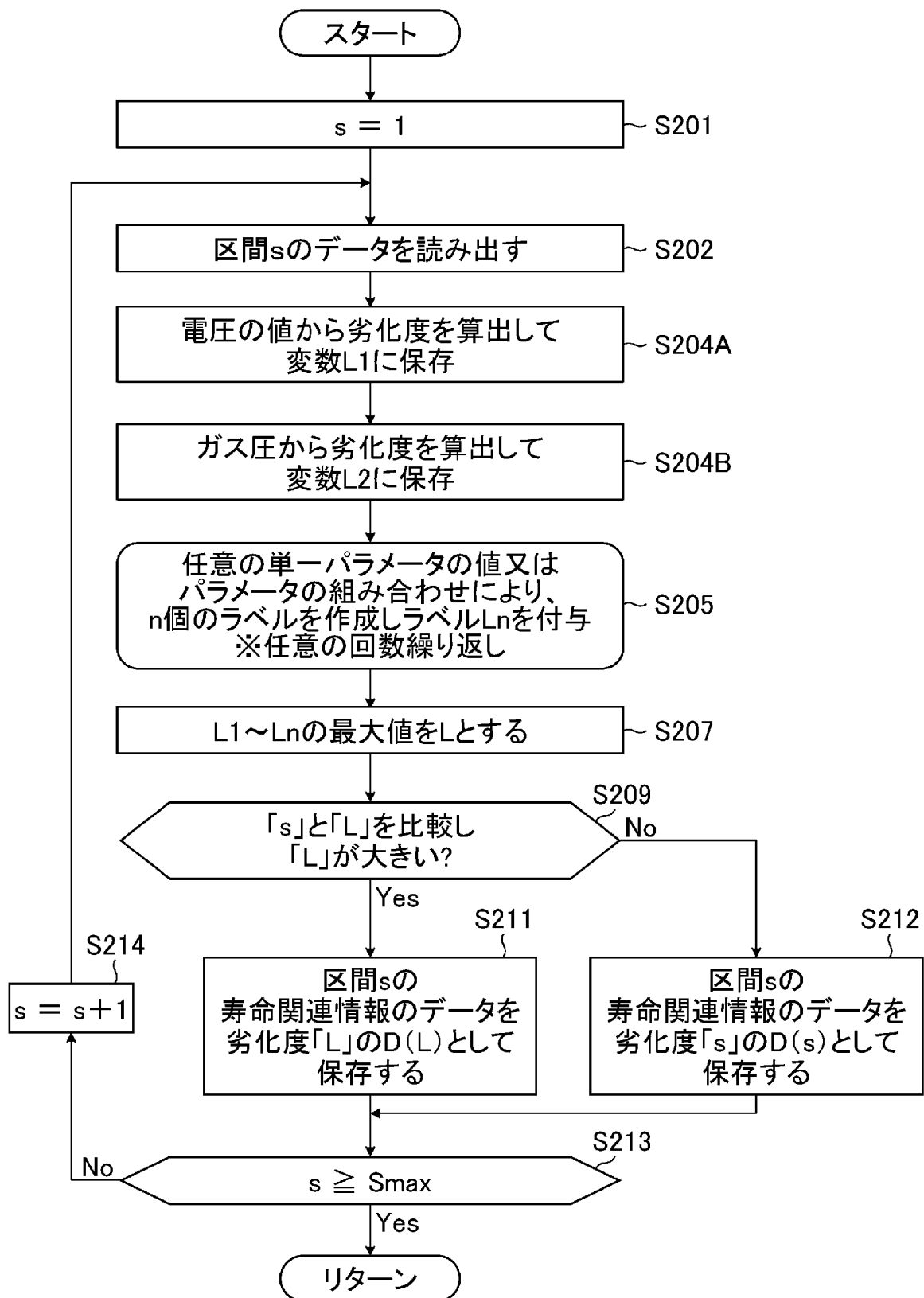
[図12]

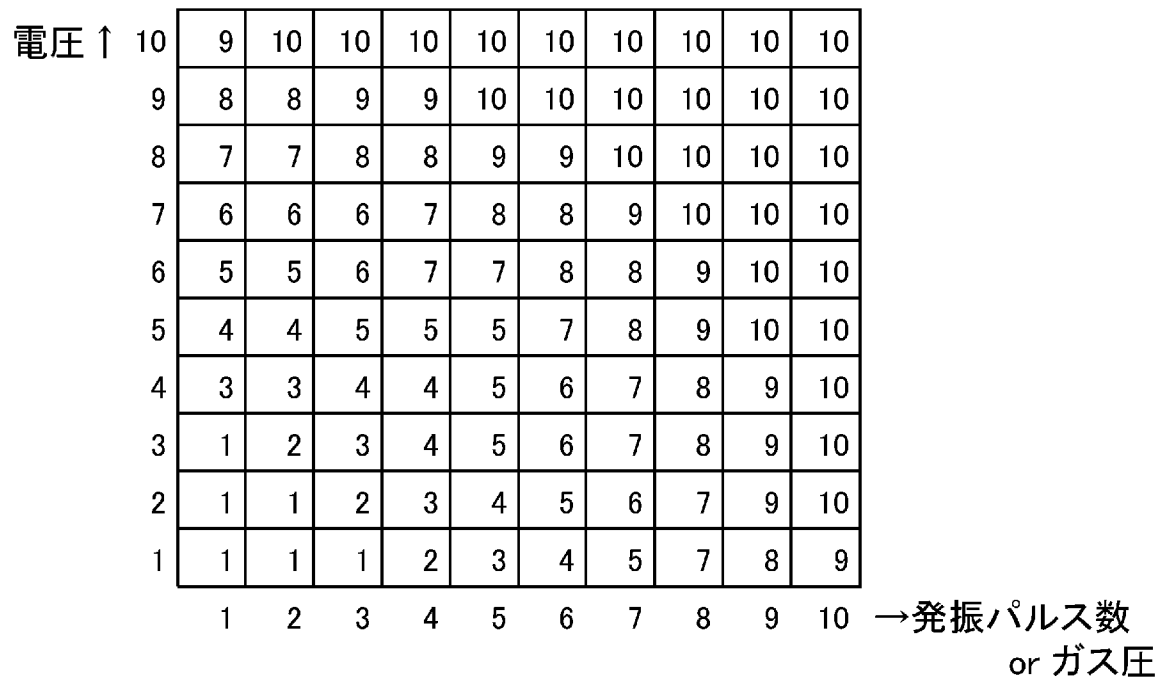
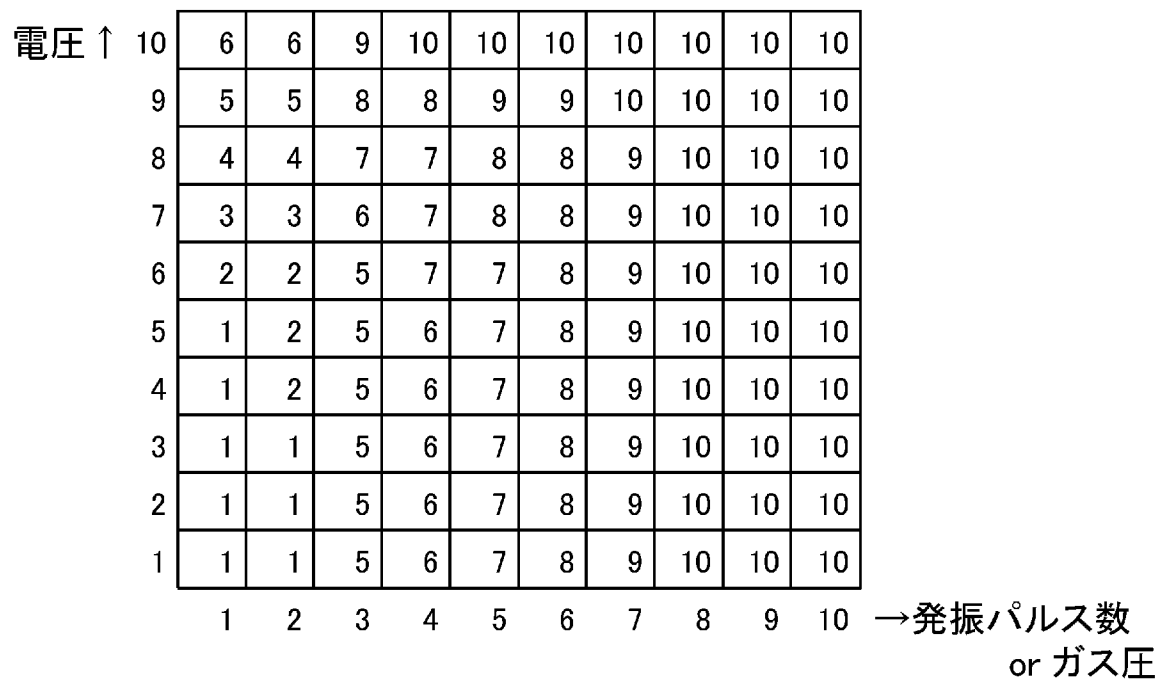


[図13]

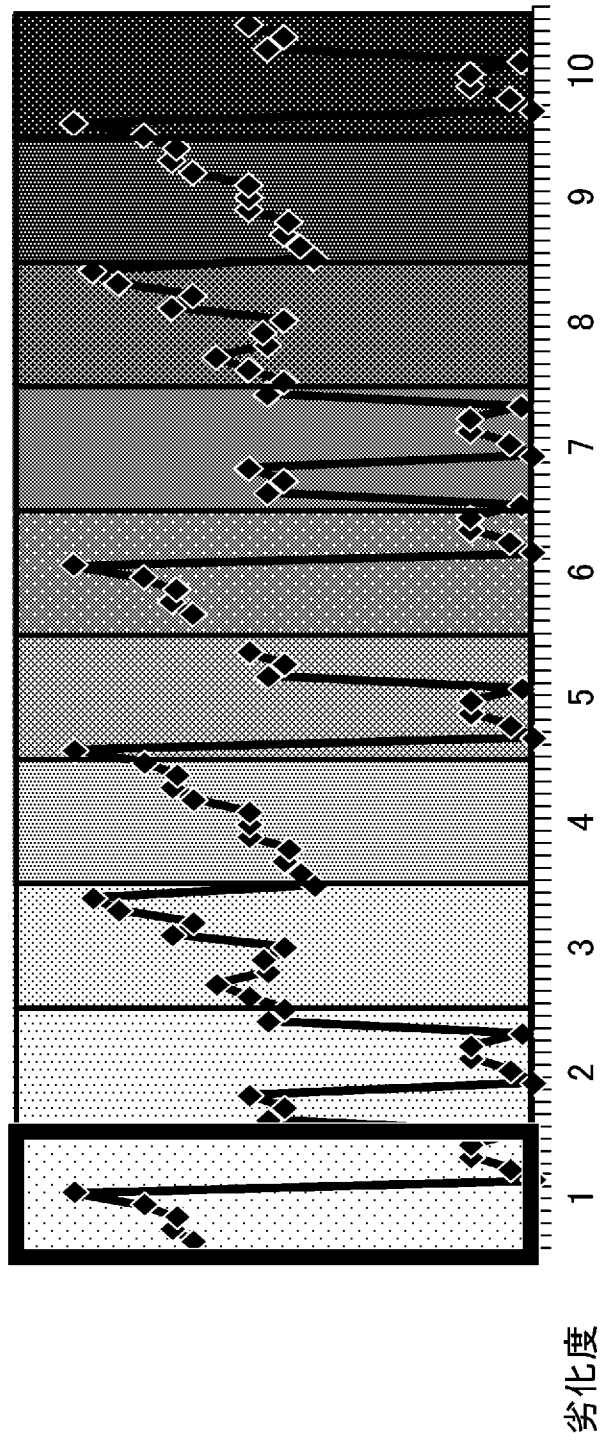


[図14]

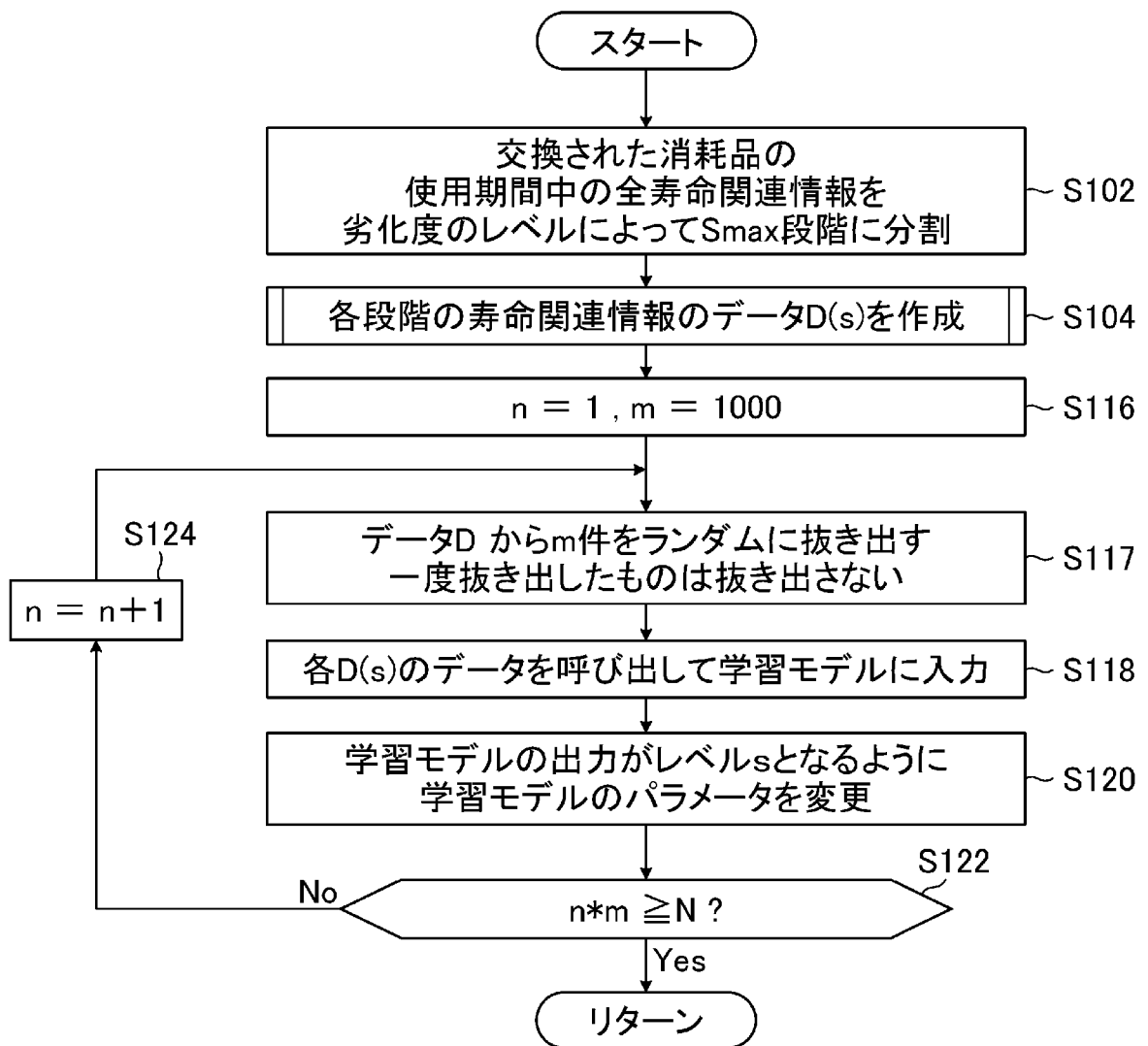




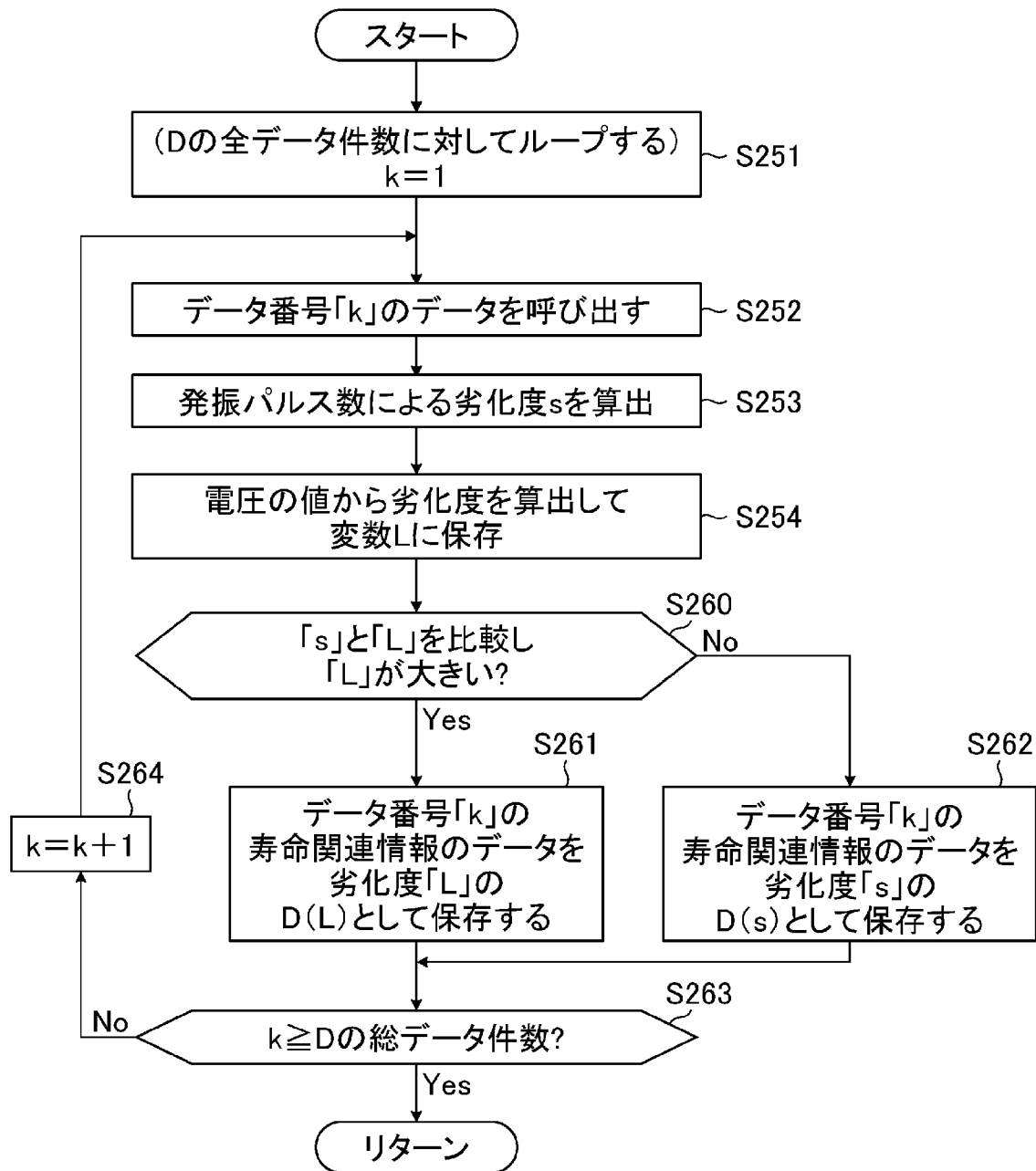
[図17]



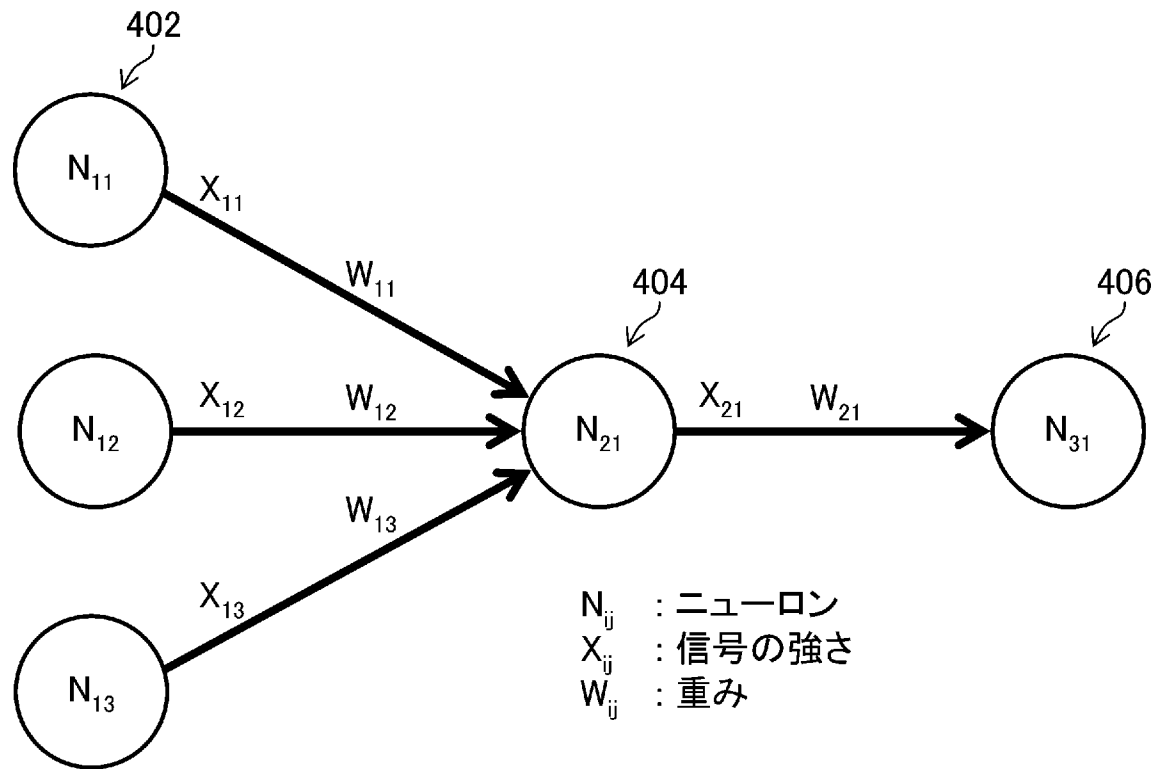
[図18]



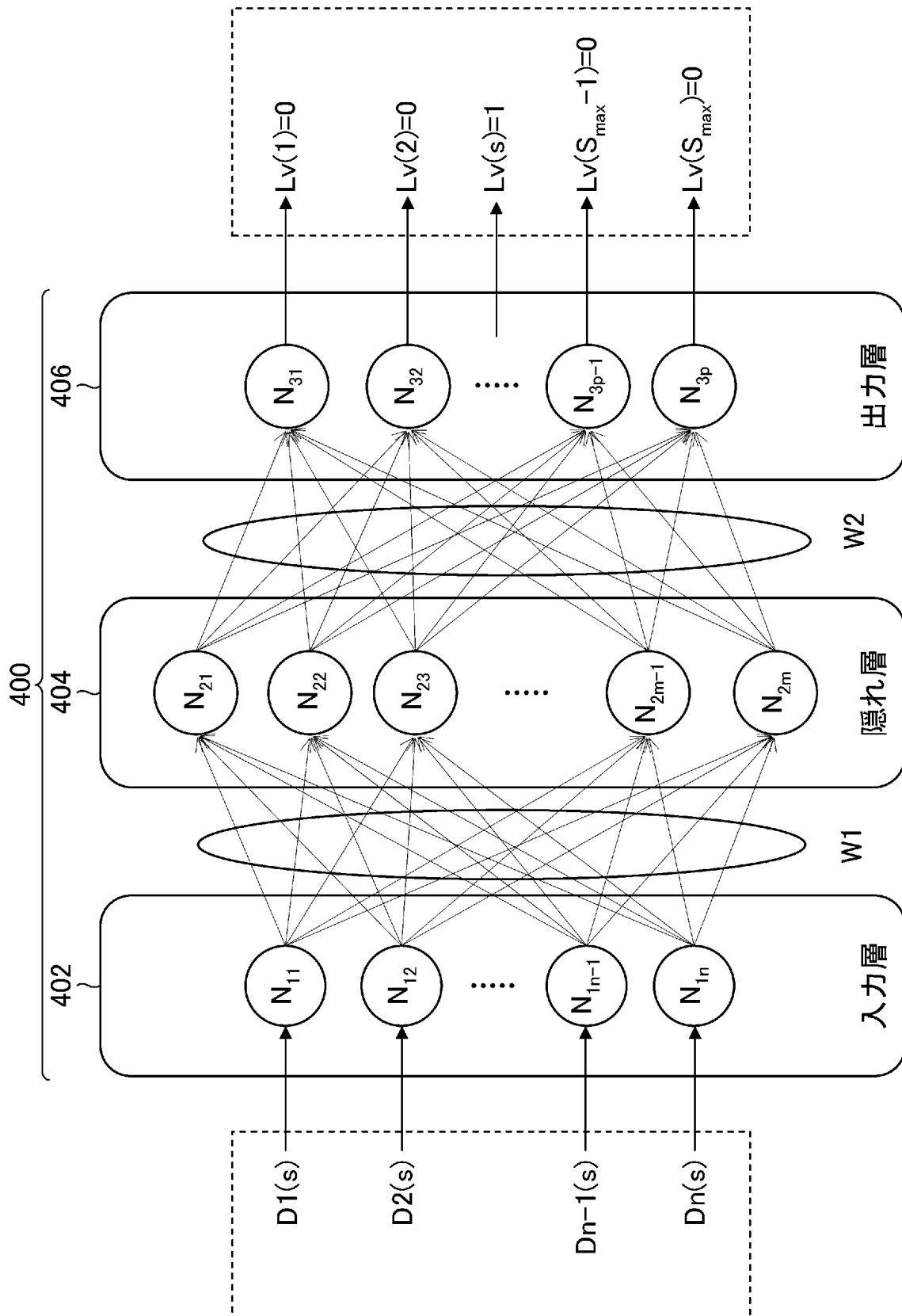
[図19]



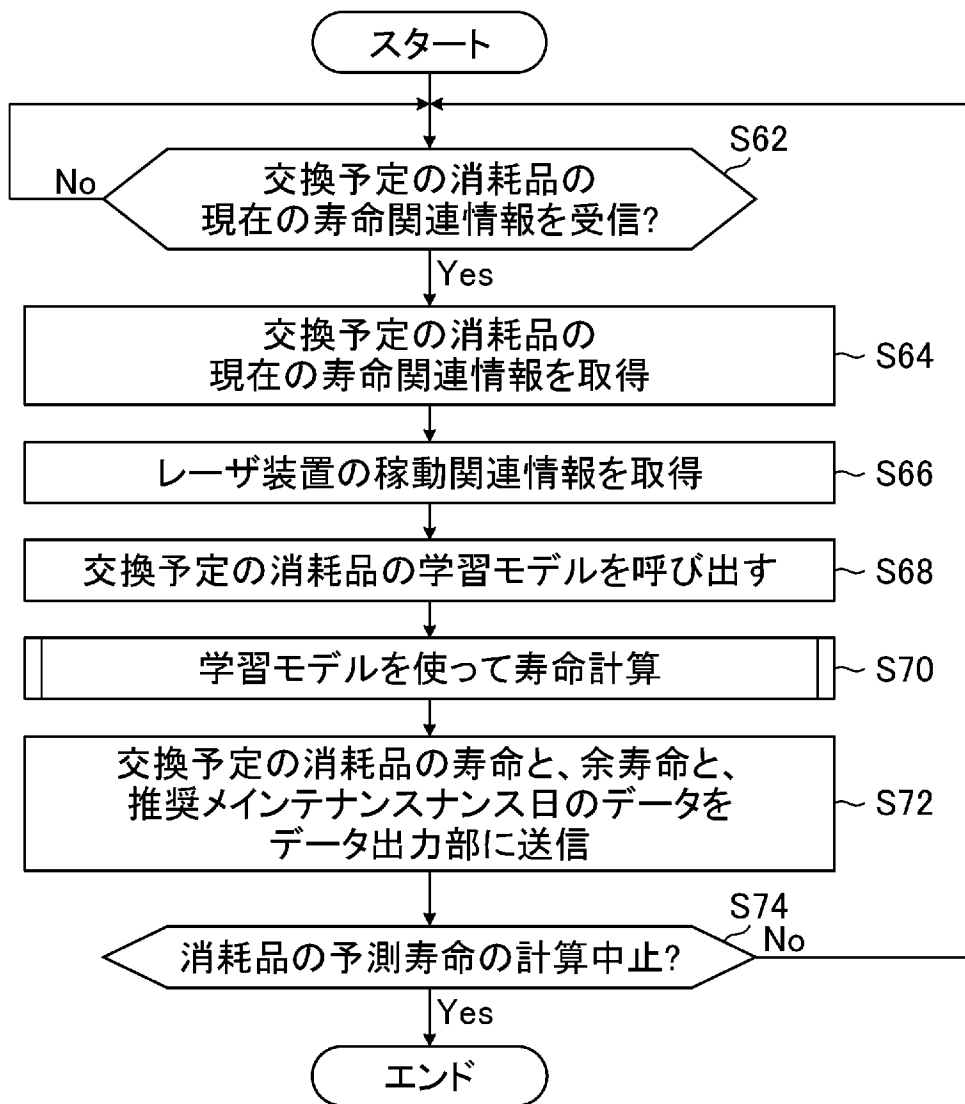
[図20]



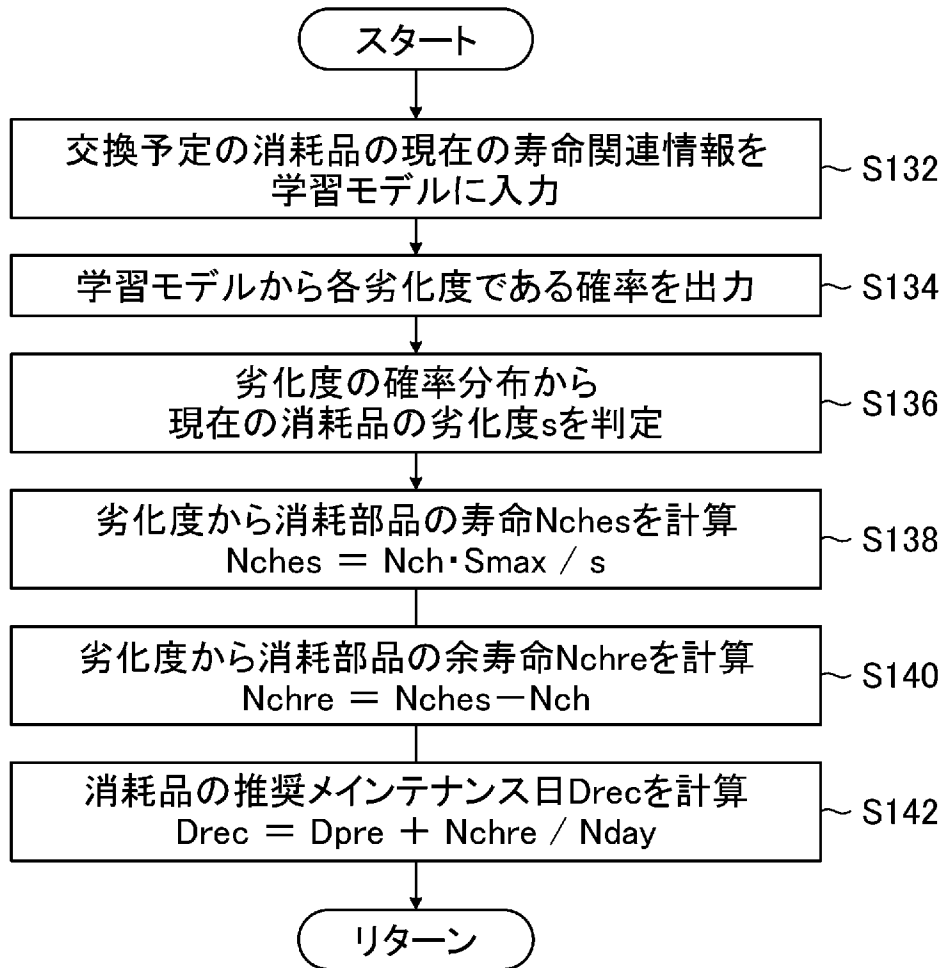
[図21]



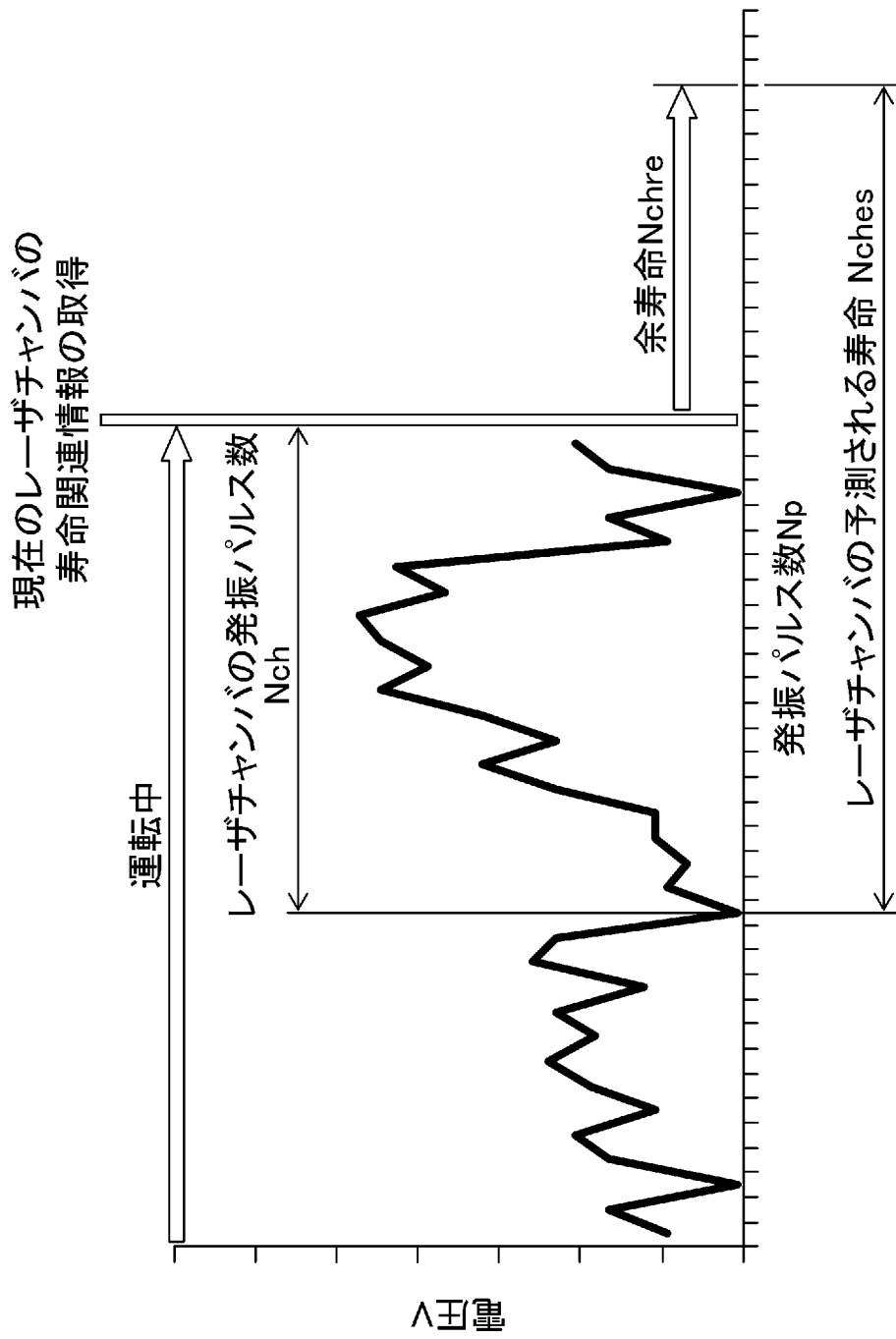
[図22]



[図23]



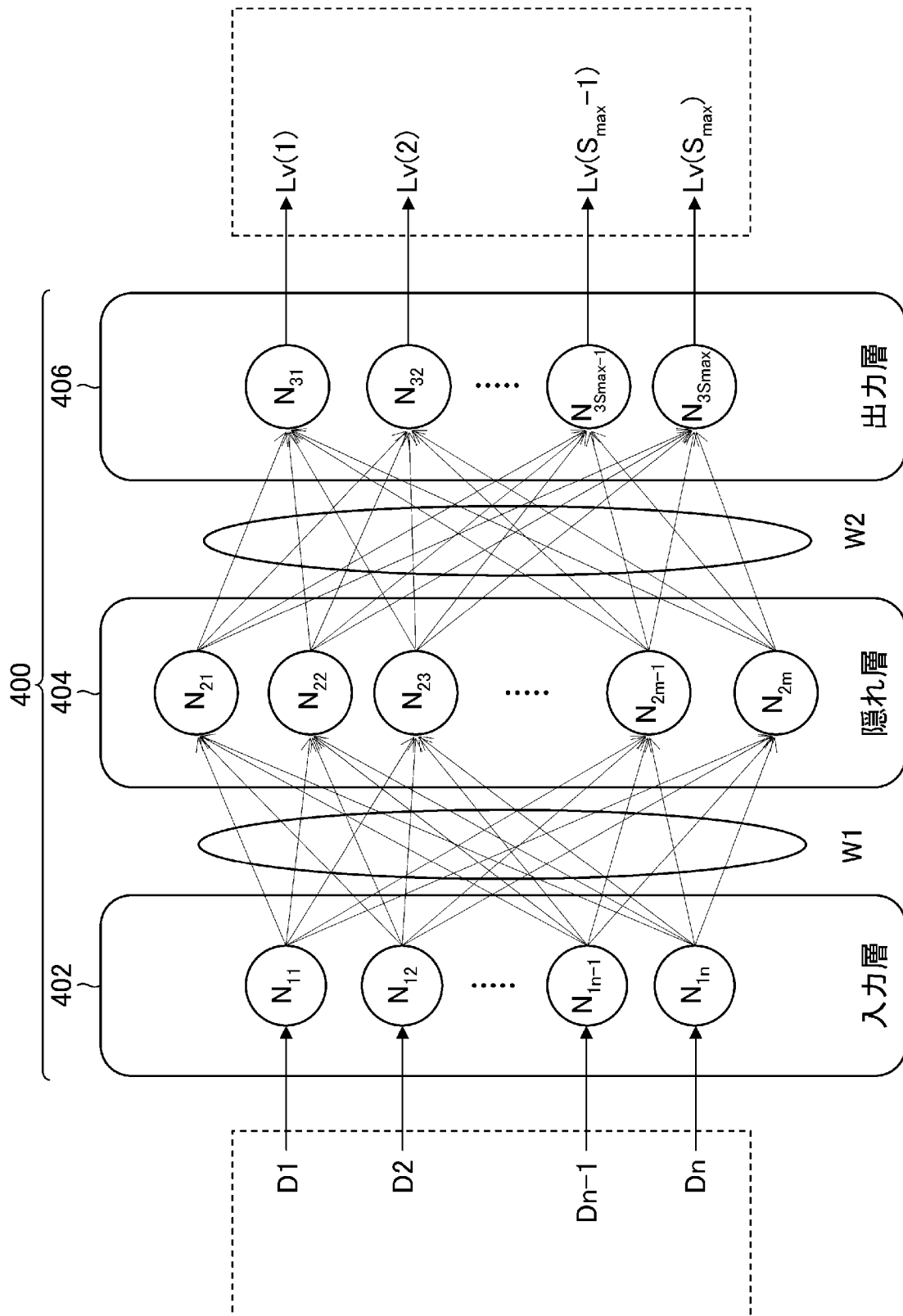
[図24]



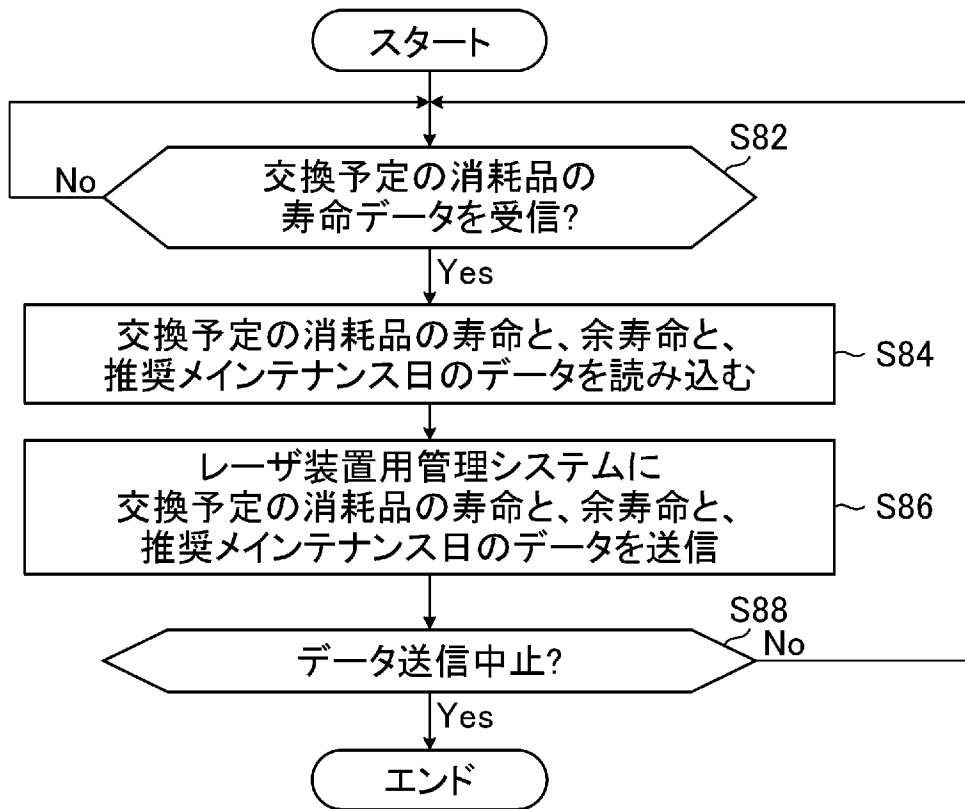
[図25]

劣化度	その劣化度である確率
Lv(1)	0.0%
Lv(2)	0.0%
Lv(3)	3.2%
Lv(4)	9.8%
Lv(5)	13.7%
Lv(6)	43.2%
Lv(7)	67.8%
Lv(8)	39.3%
Lv(9)	17.3%
Lv(10)	2.0%

[図26]



[図27]



[図28]

大項目	具体例	説明
電極劣化パラメータ	電極の放電回数	レーザチャンバの電極間で放電した回数 ($\equiv$ レーザチャンバ交換後の発振パルス数 N_p)
	スペクトル線幅	電極が劣化とスペクトル線幅 $\Delta\lambda$ と正の相関性があり、スペクトル線幅が広がると電極が劣化している傾向がある。 ここで、スペクトル線幅は、たとえば、半値全幅であってもよいし、95%のエネルギが入る幅であってもよい。
	投入エネルギー	電極への投入エネルギー E_{in} は、1回の放電による電極の劣化に比例する傾向がある。 $E_{in} = (1/2)Co \cdot V^2$ で表される。 Co: PPMの充電コンデンサ容量、V: 充電電圧
	レーザチャンバ交換後からの投入エネルギーの積算値	電極への投入エネルギーの積算値 E_{insum} は、電極の劣化の蓄積と比例する傾向にある。 $E_{insum} = E_{in(1)} + E_{in(2)} + \dots + E_{in(N_p)}$
	パルスエネルギー	レーザ装置から出力されるパルスレーザ光のパルスエネルギー E であって、平均値であってもよい。
パルスエネルギー安定性パラメータ	パルスエネルギーのばらつき	パルスエネルギーのばらつき $E\sigma = E_s / E_{av} \cdot 100(\%)$ E_s : m 個のパルスエネルギーの標準偏差値 $(E(1), E(2), \dots, E(m))$ E_{av} : m 個のパルスエネルギーの平均値 $(E(1), E(2), \dots, E(m))$
	パルスエネルギーの積算値のばらつき	パルスエネルギー積算値のばらつき $D\sigma = D_s / D_{av} \cdot 100(\%)$ D_s : o 個のパルスエネルギー積算値 D の標準偏差値 $(D(1), D(2), \dots, D(o))$ D_{av} : o 個のパルスエネルギー積算値 D の平均値 $(D(1), D(2), \dots, D(o))$ D: q 個のパルスエネルギーの積算値 D $D(1) = E(1) + E(2) + \dots + E(q)$, $D(2) = E(2) + E(3) + \dots + E(q+1)$

[図29]

大項目	具体例	説明
ガス制御 パラメータ	レーザチャンバガス圧	レーザチャンバガス圧Pは、レーザ装置から出力されるパルスレーザ光のパルスエネルギーに影響するパラメータであって、平均値であってもよい。
	充電電圧	充電電圧Vは、レーザ装置から出力されるパルスレーザ光のパルスエネルギーに影響するパラメータであって、平均値であってもよい。
	レーザチャンバ交換後からのハロゲンガス注入量の積算値	ハロゲンガスの注入量の積算値は、放電電極の劣化と相関性のあるパラメータであり、レーザ交換後からのハロゲンガスを一定量注入した回数で代用してもよい。
	単位発振パルス数当りのハロゲンガス注入量	単位発振パルス数当りのハロゲンガス注入量は、レーザチャンバの寿命末期に近づくが増加する傾向にあるパラメータ。 単位発振パルス数当りのハロゲンガス注入回数で代用してもよい。
	レーザチャンバ交換後からのレーザガス注入量の積算値	レーザチャンバ交換後からのレーザガス注入量の積算値は、チャンバ内に存在してきた不純物ガス量と相関するパラメータであって、レーザガス交換後から、レーザガスを全ガス交換したレーザガス量と部分ガス交換したレーザガス量の和の積算値であってもよい。 レーザガスの全ガス交換回数や部分ガス交換の回数で代用してもよい。
	単位発振パルス数当りのレーザガス注入量	単位発振パルス数当りのレーザガス注入量は、レーザチャンバの寿命末期に近づくが増加する傾向にあるパラメータ。 単位発振パルス数当りの全ガス交換回数や部分ガス交換の回数で代用してもよい。
	全ガス交換後の調整発振後の充電電圧	全ガス圧一定で充電電圧の制御にする場合に、全ガス交換後に調整発振を行なう。レーザ性能を回復させるための初期充電電圧Vini
	全ガス交換後の調整発振後のレーザチャンバガス圧	充電電圧が所定の範囲内となるように全ガス圧を制御する場合に、全ガス交換後に調整発振を行なう。レーザ性能を回復させるためのレーザチャンバの初期ガス圧Pini

[図30]

大項目	具体例	説明
運転負荷 パラメータ	レーザ装置から出力される レーザ光の平均出力	平均出力PWは、レーザチャンバの熱負荷に比例するパラメータ $PW = N_t \cdot E / T$ $T: \text{サンプリング時間}$ $N_t: T \text{ 時間中のパルス数}$ $E: \text{パルスエネルギー}$ パルスエネルギーEが一定でない場合は、サンプリング時間中のパルスエネルギーを 積算 (Esum) して求めてもよい。 $PW = E_{\text{sum}} / T$ $T = 30 \text{ 秒から } 3000 \text{ 秒であってもよい。}$
	バースト運転時のduty	運転負荷パラメータは、以下のパラメータで代用してもよい。 バーストON時の繰返し周波数が略一定、バーストON時のパルスエネルギーEが 略一定の場合は、バースト運転時のDutyで代用してもよい。 $\text{Duty} = \text{Don} / \text{Tb} \cdot 100 (\%)$
	ウインドウ交換後の発振パルス数	ウインドウの劣化はウインドウを交換してからの発振パルス数Npwに依存する
レーザ共振器の 光学素子の 劣化パラメータ	ウインドウ交換後の パルスエネルギーの積算値	1 光子吸収によるウインドウの劣化の蓄積パラメータW1psum $W1_{\text{sum}} = E(1) + E(2) + E(3) + \dots + E(N_{\text{pw}})$ パルスエネルギーが略一定の場合は、発振パルス数Npwで代用してもよい。
	ウインドウのパルスエネルギーの 2乗の積算値	2 光子吸収によるウインドウの劣化の蓄積パラメータW2psum $W2_{\text{psum}} = E(1)^2 + E(2)^2 + E(3)^2 + \dots + E(N_{\text{pw}})^2$ パルスエネルギーが略一定の場合は、発振パルス数Npwで代用してもよい。
	LNM交換後の発振パルス数	LNMの光学素子の劣化はLNMを交換してからの発振パルス数NpLに依存する
	LNM交換後からの パルスエネルギーの積算値	1 光子吸収による光学素子の劣化の蓄積パラメータLNM1psum $LNM1_{\text{sum}} = E(1) + E(2) + E(3) + \dots + E(N_{\text{pL}})$ パルスエネルギーが略一定の場合は、発振パルス数NpLで代用してもよい。
	LNM交換後からの パルスエネルギーの2乗の積算値	2 光子吸収による光学素子の劣化の蓄積パラメータLNM2psum $LNM2_{\text{psum}} = E(1)^2 + E(2)^2 + E(3)^2 + \dots + E(N_{\text{pL}})^2$ パルスエネルギーが略一定の場合は、発振パルス数NpLで代用してもよい。
	OC交換後の発振パルス数	OCの劣化はOCを交換してからの発振パルス数NpOに依存する
	OC交換後からの パルスエネルギーの積算値	1 光子吸収による光学素子の劣化の蓄積パラメータOC1psum $OC1_{\text{psum}} = E(1) + E(2) + E(3) + \dots + E(N_{\text{pO}})$ パルスエネルギーが略一定の場合は、発振パルス数NpOで代用してもよい。
	OC交換後からの パルスエネルギーの2乗の積算値	2 光子吸収による光学素子の劣化の蓄積パラメータOC2psum $OC2_{\text{psum}} = E(1)^2 + E(2)^2 + E(3)^2 + \dots + E(N_{\text{pO}})^2$ パルスエネルギーが略一定の場合は、発振パルス数NpOで代用してもよい。

[図31]

大項目	具体例	説明
モニタモジュールの光学素子の劣化パラメータ	モニタモジュール交換後からの発振パルス数	モニタモジュールの光学素子の劣化はモニタモジュールを交換してからの発振パルス数NpMiに依存する
	モニタモジュール交換後からのパルスエネルギーの積算値	1光子吸収によるウインドウの劣化の蓄積パラメータMM1psum $MM1sum = E(1) + E(2) + E(3) + \dots + E(NpM)$ パルスエネルギーが略一定の場合は、発振パルス数NpMで代用してもよい。
	モニタモジュール交換後からのパルスエネルギーの2乗の積算値	2光子吸収によるウインドウの劣化の蓄積パラメータMM2psum $MM2psum = E(1)^2 + E(2)^2 + E(3)^2 + \dots + E(NpM)^2$ パルスエネルギーが略一定の場合は、発振パルス数NpMで代用してもよい。
光センサの劣化パラメータ	イメージセンサの検出光強度	イメージセンサの検出光強度は、イメージセンサの劣化パラメータとなりえる。イメージセンサは、レーザ光に照射されると検出感度が劣化する。具体的には、エタロン分光器により生成される干渉縞のピーク光強度またはイメージセンサの各チャネルの検出光強度の積分値であってもよい。
	スペクトル線幅	イメージセンサのピーク強度は、スペクトル線幅によって変化する。スペクトル線幅が太くなるとピーク強度は低くなる。ここで、スペクトル線幅は、たとえば、半値全幅であってもよい、95%のエネルギーが入る幅であってもよい。
	パルスエネルギー	イメージセンサのピーク強度は、パルスエネルギーによって変化する。スペクトル線幅が太くなるとピーク強度は低くなる。
	パルスエネルギーの積算値	モニタモジュールを交換してからの露光量に依存するので、モニタモジュールを交換してからのパルスエネルギーの積算値MMpsum $MMpsum = E(1) + E(2) + E(3) + \dots + E(NpM)$ パルスエネルギーが略一定の場合は、発振パルス数NpMで代用してもよい。

[図32]

大項目	具体例	説明
LNMの光学素子の劣化パラメータ	LNM交換後からの発振パルス数	LNMの光学素子の劣化はLNMを交換してからの発振パルス数NpLに依存する
	LNM交換後からのパルスエネルギーの積算値	1光子吸収による光学素子の劣化の蓄積パラメータLNM1psum $\text{LNM1sum} = E(1) + E(2) + E(3) + \dots + E(\text{NpL})$ パルスエネルギーが略一定の場合は、発振パルス数NpLで代用してもよい。
	LNM交換後からのパルスエネルギーの2乗の積算値	2光子吸収による光学素子の劣化の蓄積パラメータLNM2psum $\text{LNM2psum} = E(1)^2 + E(2)^2 + E(3)^2 + \dots + E(\text{NpL})^2$ パルスエネルギーが略一定の場合は、発振パルス数NpLで代用してもよい。
波長アクチュエータ劣化パラメータ	波長安定性	波長安定性は、波長の標準偏差値 $\lambda \sigma$ であって、波長アクチュエータである。たとえば、プリズムの回転ステージの劣化度の指標となることがある。 波長安定性のばらつき $\lambda \sigma = \text{標準偏差値}(\lambda(1), \lambda(2), \dots, \lambda(m))$ m: サンプル数
波面劣化のパラメータ	スペクトル線幅	スペクトル線幅 $\Delta \lambda$ は、LNM内の光学素子の透過波面または回折波面が歪みの指標となることがある。 ここで、スペクトル線幅は、たとえば、半値全幅であってもよいし、95%のエネルギーが入る幅であってもよい。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2020/028095

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl. H01S3/00 (2006.01)

FI: H01S3/00 G, H01S3/00 A

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl. H01S3/00-3/30

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996

Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2020

Registered utility model specifications of Japan 1996-2020

Published registered utility model applications of Japan 1994-2020

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2012-253383 A (GIGAPHOTON INC.) 20 December 2012, entire text, all drawings	1-19
A	JP 2000-306813 A (NIKON CORP.) 02 November 2000, entire text, all drawings	1-19
A	WO 2014/017562 A1 (GIGAPHOTON INC.) 30 January 2014, entire text, all drawings	1-19

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
09.09.2020

Date of mailing of the international search report
24.09.2020

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2020/028095

Patent Documents referred to in the Report	Publication Date	Patent Family	Publication Date
JP 2012-253383 A	20.12.2012	US 6697695 B1 entire text, all drawings	
JP 2000-306813 A	02.11.2000	EP 1150401 A2 (Family: none)	
WO 2014/017562 A1	30.01.2014	US 2015/0139258 A1 entire text, all drawings	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） H01S 3/00(2006.01)i FI: H01S3/00 G; H01S3/00 A														
B. 調査を行った分野														
調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） H01S3/00-3/30														
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922 - 1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971 - 2020年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996 - 2020年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994 - 2020年</td> </tr> </table>			日本国実用新案公報	1922 - 1996年	日本国公開実用新案公報	1971 - 2020年	日本国実用新案登録公報	1996 - 2020年	日本国登録実用新案公報	1994 - 2020年				
日本国実用新案公報	1922 - 1996年													
日本国公開実用新案公報	1971 - 2020年													
日本国実用新案登録公報	1996 - 2020年													
日本国登録実用新案公報	1994 - 2020年													
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）														
C. 関連すると認められる文献														
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号												
A	JP 2012-253383 A（ギガフォトン株式会社）20.12.2012（2012 - 12 - 20） 全文全図	1-19												
A	JP 2000-306813 A（株式会社ニコン）02.11.2000（2000 - 11 - 02） 全文全図	1-19												
A	WO 2014/017562 A1（ギガフォトン株式会社）30.01.2014（2014 - 01 - 30） 全文全図	1-19												
☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。														
<table border="0"> <tr> <td>* 参考文献のカテゴリー</td> <td>“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの</td> </tr> <tr> <td>“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの</td> <td>“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの</td> </tr> <tr> <td>“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの</td> <td>“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの</td> </tr> <tr> <td>“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）</td> <td>“&” 同一パテントファミリー文献</td> </tr> <tr> <td>“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献</td> <td></td> </tr> <tr> <td>“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献</td> <td></td> </tr> </table>			* 参考文献のカテゴリー	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの	“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの	“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの	“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの	“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	“&” 同一パテントファミリー文献	“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献	
* 参考文献のカテゴリー	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの													
“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの	“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの													
“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの													
“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	“&” 同一パテントファミリー文献													
“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献														
“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献														
国際調査を完了した日 09.09.2020	国際調査報告の発送日 24.09.2020													
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	権限のある職員（特許庁審査官） 村井 友和 2K 3207 電話番号 03-3581-1101 内線 3255													

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2020/028095

引用文献			公表日	パテントファミリー文献	公表日
JP	2012-253383	A	20.12.2012	US 6697695 B1 全文全図 EP 1150401 A2	
JP	2000-306813	A	02.11.2000	(ファミリーなし)	
WO	2014/017562	A1	30.01.2014	US 2015/0139258 A1 全文全図	